การผลิตก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพื่อการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

PRODUCTION OF HYDROGEN PEROXIDE GAS FROM PHOTOCATALYSIS FOR SURFACE DISINFECTION

TANONGSAK SUKKASEM

ลัยเทคโนโลยีสุรมา

ราวักยา

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Mechanical and Process System Engineering Suranaree University of Technology Academic Year 2022

การผลิตก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพื่อการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

9121P

(อ. ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด) ประธานกรรมการ

אונזהל הגבאק

(อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์) <mark>ก</mark>รรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

brami

(อ. ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

มารินา เกตุทัต-คาร์นส์) กรรมการ

(รศ. ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์) กรรมการ

(ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง) กรรมการ

(รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

(รศ. ดร.พรศิริ จงกล) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นายทนงศักดิ์ สุขเกษม : การผลิตก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากกระบวนการโฟโตคะตะ ไลซิสเพื่อการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว (PRODUCTION OF HYDROGEN PEROXIDE GAS FROM PHOTOCATALYSIS FOR SURFACE DISINFECTION) อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์, 135 หน้า.

คำสำคัญ : โฟโตคะตะไลซิส; ก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์; TiO₂/SiO₂; ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง; การฆ่าเชื้อบนพื้นผิว; ความชื้นสัมพัทธ์

งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตก๊าซ H2O2 จากกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเพื่อการฆ่าเชื้อบน พื้นผิว แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกค<mark>ือส</mark>ร้างเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสสำหรับระบบก๊าซ และทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย ส่วนที่สองคือหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ ้H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ส่วน<mark>ท</mark>ี่สามค<mark>ือ</mark>ศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ ส่วนที่สี่คือทดสอบการกระจ<mark>า</mark>ยตัวขอ<mark>งก๊า</mark>ซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ในห้องจำลองปริมาตร 0.027 m³ ร่วมกับการทดสอบฆ่าเชื้อ *E. coli* และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอาหาร ส่วนสุดท้ายคือ ้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ<mark>ข</mark>องเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์สำหรับ ้กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสข<mark>องร</mark>ะบบก๊าซมีส่วนประ<mark>กอบ</mark>สำคัญ ได้แก่ วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสง แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต พัดลมระบายอากาศ และแผ่นกรองอากาศ จากการศึกษา พบว่ากระบวนการโฟโตค<mark>ะต</mark>ะไลซ<mark>ิสสามารถสังเคราะห์ก๊า</mark>ซ H₂O₂ ได้สูงสุดที่ค่า 3 ppmv โดยเครื่อง ปฏิกรณ์อนุกรม 3 หน่ว<mark>ย สภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ คว</mark>ามชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่ากับ 60-65% RH ้อัตราการไหลของอาก<mark>าศเท่า</mark>กับ 12.0 เมตรต่อวินาที ตัวเร่<mark>งปฏิกิ</mark>ริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/1%SiO₂ อนุภาค SiO₂ ต่ำกว่า 63 ไม<mark>โครเมตร การปรับปรุงทางสัณฐานวิ</mark>ทยาตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ด้วย SiO₂ ้ก่อให้เกิดโครงสร้างรูพรุนบนพื้<mark>นผิวและมีการเกิดโครงสร้างแล</mark>ะหมู่พันธะ Ti–O–Si ซึ่งมีบทบาทในการ ้ดักจับอิเล็กตรอนและโฮลบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาและเพิ่มหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้น ซึ่งมีผลในการดึงดูด โมเลกุลสารตั้งต้น จากผลการทดสอบด้วย XRD พบว่ามีการเกิดโครงสร้างเฟสผสมระหว่าง อนาเทส/ รูไทล์/อสัณฐาน ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงวิถีทางของอิเล็กตรอนและโฮลในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ้จากการทดสอบในห้องจำลองพบว่าก๊าซ H₂O₂ ที่กระจายตัวในห้องจำลองมีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ บนพื้นผิวแห้งเป็นหลัก การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H2O2 เหมาะสำหรับ การใช้งานด้านการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแห้ง กลุ่มลูกค้ามีความสนใจผลิตภัณฑ์ในประเด็นการใช้งานไม่ ้จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนการใช้งานผลิตภัณฑ์เดิมมาใช้เทคโนโลยีก๊าซ H_2O_2

สาขาวิชา<u> วิศวกรรมเคมี</u> ปีการศึกษา <u>2565</u> ลายมือชื่อนักศึกษา <u>ทางสักลิ์</u> สาย_เกษม</sub> ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา <u>สารธรร</u> จังกร่องอาง ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม *M. Chronni* TANONGSAK SUKKASEM : PRODUCTION OF HYDROGEN PEROXIDE GAS FROM PHOTOCATALYSIS FOR SURFACE DISINFECTION. THESIS ADVISOR : SUPUNNEE JUNPIROM, Ph.D. 135 PP.

Keywords : photocatalysis; hydrogen peroxide gas; TiO₂/SiO₂; photocatalyst; surface disinfections; relative humidity

This work aimed to study the production of hydrogen peroxide gas (H_2O_2) from photocatalysis for surface disinfection. There are five main parts. The first part is to fabricate the photocatalytic reactor for gas systems and test the feasibility of research. The second part involves the investigation of the optimal conditions for synthesis of H_2O_2 gas from humidity in the air. The third part is to study the role of SiO₂ in TiO₂/SiO₂. The fourth part is the investigation of the distribution of synthesized H_2O_2 in the chamber of 0.027 m³ with the *E. coli* disinfection and food surface disinfection. The last part provides a business plan to assess the feasibility of H_2O_2 gas technology. The reactor for the gas system was fabricated including the main components; photocatalyst material, UV light source, ventilation fan and air filter. From the results showned that the fabricated reactor with 3 series of coated photocatalyst supporting plates can synthesize the H_2O_2 gas up to 3 ppmy with optimal conditions of relative humidity at 60-65% RH, an air flow rate of 12.0 m/s with the TiO₂/1%SiO₂ consisting of the SiO₂ particle is less than 63 μ m. Modification of TiO₂ morphology with SiO₂ created the pore structure on the surface. There is the formation of Ti–O–Si structures which plays a role in electron and hole trapping on the photocatalyst surface and adding the hydroxyl groups on the surface to attract the reactant molecules. The XRD results showed that there is the appearance of the mixed phase structure between anatase/ rutile/amorphous, this resulting structure improves the electron and hole pathways in the photocatalyst. The dispersed H_2O_2 gas in the simulation chamber showed that it did work well for dry surfaces. The feasibility was studied for business assessment of H_2O_2 gas technology to be suitable for the application of dry surface disinfection. The target group of the customer is interested in this product due to its advantage of unlimited usage. It is the main motivation to switch traditional products to be the H_2O_2 gas technology.

School of <u>Chemical Engineering</u> Academic Year <u>2022</u> Student's Signature <u>Janongsak</u> <u>Sukkasem</u> Advisor's Signature <u>SUPUNNEE</u> J. Co-Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือ คำแนะนำ และความ กรุณาจากบุคคลผู้มีพระคุณหลายท่าน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ

อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความรู้ คำปรึกษา ชี้แนะ อบรมสั่งสอน และคอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งช่วยตรวจทาน และแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ รองศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์ ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง ที่กรุณา สละเวลาตรวจแก้ไขและให้คำชี้แนะเพิ่มเติมในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ และ ดร.สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และคำปรึกษาแนะนำ การทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* และ ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ

วิเคราะห์ขั้นสูงในการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาในงานวิจัยนี้ งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการยกระดับเทคโนโลยีสู่ ภาคอุตสาหกรรมจากเทคโนธานี เพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งทุนในการนำเสนอ ผลงานในประเทศ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณศรัณย์ ดอกไม้กุล เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี และบุคลากรประจำศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ ต่าง ๆ ในการทำวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์ นายสุพิชญา ศรีอำไพ และนางสาว แพรวพรรณ พลเยี่ยม ที่ให้คำแนะนำและวางแผนการต่อยอดเทคโนโลยีในงานวิจัยสู่มุมมองการตลาด และธุรกิจ นายณัฐภัทร พูลสวัสดิ์ นายปุญญพัฒน์ คำรณฤทธิ์ นายศิรวิชญ์ โพธิ์ทองงาม นักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (SCIUS) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่ร่วมศึกษาหาสภาวะการ สังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ และทดสอบการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอาหาร รวมถึงเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ที่คอย ช่วยเหลือและให้กำลังใจในการทำวิจัยนี้

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การอุปการะอบรม เลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา ส่งเสียค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และเป็นกำลังใจจนกระทั่ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ

ทนงศักดิ์ สุขเกษม

สารบัญ

บทคัดย่	อ (ภาษา	ปัทย) <u></u>	<u>ิ</u> ก	
บทคัดย่	บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)ข			
กิตติกระ	กิตติกรรมประกาศค			
สารบัญ <u></u>			ঀ	
สารบัญ	ตาราง <u></u>	<u> </u>		
สารบัญ	รูป		_ณ	
บทที่				
1	บทน <u>ำ</u>		_1	
	1.1	ความสำคัญขอ <mark>งปัญ</mark> หา	1	
	1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษา	_2	
	1.3	สมมติฐานของการศึกษา	_3	
	1.4	ขอบเขตของการศึกษา	<u>3</u>	
2	ปริทัศน์	ริทัศน์วรรณก <mark>รรมแ</mark> ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		
	2.1	แนวความคิ <mark>ดการสังเคราะห์</mark> H ₂ O ₂ <mark>จากกลไกร่าง</mark> กายของมนุษย์	_4	
	2.2	? พื้นฐานของกระบวน <mark>การโฟโตคะตะไลซิส</mark> ร		
2.2.1 กระบวนการดูดซับบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา		5		
		2.2.2 กระบวนการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา	.8	
		2.2.3 องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส	9	
		2.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส	11	
	2.3	บทบาทของ SiO ₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO ₂ /SiO ₂ สำหรับกระบวนการโฟโตคะ		
	ตะไลซิส		13	
		2.3.1 ผลกระทบของ SiO ₂ ต่อพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา		
		TiO ₂ /SiO ₂	13	
		2.3.2 กระทบของ SiO ₂ ต่อขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO ₂ /SiO ₂	13	
		2.3.3 ผลกระทบของ SiO ₂ ต่อความเป็นกรดบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา		
TiO ₂ /SiO ₂			14	

สารบัญ (ต่อ)

3

	2.3.4	กระทบของ SiO2 ต่อแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยา	
		TiO ₂ /SiO ₂	15
2.4	การปร	ะยุกต์ใช้กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสกับการกำจัดเชื้อจุลชีพและ	
	มลพิษส์	อินทรีย์	15
วิธีการ	ดำเนินง	านวิจัย	17
3.1	วิธีการ	ทดลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย	
	3.1.1	สารเคมีและอปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	18
	3.1.2	วิธีการทดลอง	19
3.2	วิธีการ	ทดลองเพื่อหา <mark>สภ</mark> าวะที่เหม <mark>าะส</mark> มในการสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ และ	
	การ ศึก	าษาบทบ <mark>าทข</mark> อง SiO ₂ ในกร <mark>ะบว</mark> นการโฟโตคะตะไลซิส	_25
	3.2.1	สารเค <mark>มีแล</mark> ะอุปก <mark>รณ์ที่ใช้ในการ<mark>ทุด</mark>ลอง</mark>	25
	3.2.2	วิธีก <mark>า</mark> รปรับปรุงการสังเคราะห์ตัวเร่ <mark>งป</mark> ฏิกิริยาด้วยแสงและการออกแบง	J
		การทุด <mark>ลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะ</mark> สมในการสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ และ	
		บทบาทของ SiO ₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	26
3.3	วิธีการ	<mark>ทดลอ</mark> งเพื่อทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ H ₂ O2 ที่สังเคราะห์ได้	29
	3.3.1	<mark>ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองเพื่อทด</mark> สอบการกระจายตัวของก๊าซ	
	C.	H ₂ O ₂ ที่ <mark>สังเคราะห์ได้ และผลกระทบ</mark> ของการเพิ่มหน่วยการเกิดปฏิกิริย	า
	1	ของเครื่องปฏิกรณ์	_31
3.4	วิธีการ	ทดสอบการยับยั้งเชื้อในอากาศและพื้นผิวด้วยก๊าซ H ₂ O ₂ ที่สังเคราะห์	
	ได้จากเ	เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส	32
	3.4.1	สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	<u>.</u> 32
	3.4.2	การสังเคราะห์อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Luria-Bertani (LB) liquid	
		medium	32
	3.4.3	การติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว	
		ของอาหารด้วยก๊าซ H ₂ O ₂ ที่สังเคราะห์ได้	33
3.5	เครื่องว์	มือวิเคราะห์ขั้นสูงในงานวิจัย	37
3.6	การปร	ะเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H ₂ O ₂ เบื้องต้น	_38

หน้า

สารบัญ (ต่อ)

4	ผลการ	ผลการวิจัยและอภิปรายผล		<u>.</u> 39
	4.1	ผลการ	ทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย	39
		4.1.1	คุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด TiO ₂ SiO ₂ และ TiO ₂ /SiO ₂	39
		4.1.2	การทดสอบเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสสำหรับการสังเคราะห์	
			ก๊าซ H ₂ O ₂ จากคว <mark>าม</mark> ชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการ	
			โฟโตคะตะไลซิส . 1	50
	4.2	ผลการ	หาสภาวะที่เหมา <mark>ะส</mark> มในก <mark>า</mark> รสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ จากความชื้นสัมพัทธ์	
		ในอากา	าศด้วยกระบวนก <mark>า</mark> รโฟโตค <mark>ะ</mark> ตะไลซิส	56
		4.2.1	ผลกระทบข <mark>องค</mark> วามชื้นสั <mark>มพัท</mark> ธ์ในอากาศสำหรับการสังเคราะห์	
			ก๊าซ H ₂ O ₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส	56
		4.2.2	ผลกร <mark>ะทบ</mark> ของความเร็วของอา <mark>กาศ</mark> สำหรับการสังเคราะห์ก๊าซ	
			H ₂ O ₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส	60
		4.2.3	ผลกระทบของขนาดอนุภาค SiO ₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO ₂ /SiO ₂	
			สำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส	61
		4.2.4	ผลกระทบของสัดส่วนระหว่าง TiO ₂ กับ SiO ₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา	
			TiO ₂ /SiO ₂ สำหรับสังเคร <mark>าะห์ก๊าซ</mark> H ₂ O ₂ ด้วยกระบวนการ	
		C.	โฟโตคะตะไลซิส	_63
	4.3	บทบาท	เของ SiO2 ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO2/SiO2 สำหรับกระบวนการ	
		โฟโตคะ	ะตะไลซิส าสยเทคโนโลย จะ	65
		4.3.1	ผลกระทบของ SiO2 ต่อโครงสร้างเฟสและขนาดผลึกของตัวเร่ง	
			ปฏิกิริยาด้วยแสง TiO ₂ /SiO ₂	66
		4.3.2	 ผลกระทบของ SiO2 ต่อพื้นที่ผิวจำเพาะ ปริมาตรรูพรุน และขนาด	
			รูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO ₂ /SiO ₂	69
		4.3.3	ผลกระทบของ SiO2 ต่อแถบช่องว่างพลังงานตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	
			TiO ₂ /SiO ₂	70
		4.3.4	ผลกระทบของ SiO2 ต่อหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	
			TiO ₂ /SiO ₂	76

หน้า

สารบัญ (ต่อ)

	10-				
	4.3.5	ผลกระทบของ SiO2 ตอลกษณะพนผวของตวเรงปฏกรยาดวยแสง			
	TiO ₂ /SiO ₂ ที่ถูกเคลื่อบลงบนพื้นผิววัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา		77		
	4.3.6	ผลกระทบของ SiO ₂ ต่ออิเล็กตรอนคู่โดดเดียวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย	J		
		แสง TiO ₂ /SiO ₂	84		
4.4	ผลการ	กระจายตัวของก๊าซ H ₂ O ₂ ที่สังเคราะห์ได้ในห้องจำลองและการทดสอง	J		
	การฆ่าเชื้อ <i>E. coli</i> และการ <mark>ฆ่าเชื</mark> ้อบนพื้นผิวของอาหาร				
4.5 ผลการวิเคราะห์ความเป็น <mark>ไปได้ทา</mark> งธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H ₂ O ₂		วิเคราะห์ความเป็น <mark>ไปได้ทา</mark> งธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H ₂ O ₂	101		
	4.5.1	การวิเคราะห์แน <mark>ว</mark> โน้มท <mark>า</mark> งการตลาด	101		
	4.5.2	การวิเคราะห์ต <mark>ล</mark> าดเป้าห <mark>ม</mark> าย	101		
	4.5.3	การวิเคราะ <mark>ห์กลุ่</mark> มลูกค้าเป <mark>้าห</mark> มาย	102		
	4.5.4	ความต้ <mark>องกา</mark> รต่ำสุ ดขอ งผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มลูกค้ายอมรับได้ <u></u>	102		
	4.5.5	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	103		
5 9190059	I		106		
ว บทธิมุบ	,		100		
5.1	สรุปผล	งานวิจัย	106		
	5.1.1	สรุปผลการทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย	106		
	5.1.2	<mark>สรุปผลก</mark> ารหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ จาก			
	5	ควา <mark>มชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบ</mark> วนการโฟโตคะตะไลซิส	107		
	5.1.3	สรุปบทบาท SiO ₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO ₂ /SiO ₂ สำหรับ			
		กระบวนการ โฟโตคะตะไลซิส	107		
	5.1.4	สรุปผลการกระจายตัวของก๊าซ H ₂ O ₂ ที่สังเคราะห์ได้ในห้องจำลอง			
		และการทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของ			
		อาหาร	108		
	5.1.5	สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ			
		Н ₂ O ₂			
5.2	ข้อเสน	อแนะ			
รายการอ้างอิง			110		
ภาคผนวก			117		
ภาคผน	ภาคผนวก ก 117				
ประวัติผู้เขียน <u></u>			120		

หน้า

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

2.1	ปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส <u>.</u>	12
2.2	พื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO ₂ /SiO ₂	14
3.1	ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษาความเป็น <mark>ไป</mark> ได้ของงานวิจัย	24
3.2	ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษาหาสภาว <mark>ะ</mark> ที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ และ	
	การศึกษาบทบาทของ SiO ₂ ในกระบ <mark>วนการโ</mark> ฟโตคะตะไลซิส	27
3.3	ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการกร <mark>ะ</mark> จายตั <mark>ว</mark> ของก๊าซ H ₂ O ₂ ในห้องจำลอง	31
4.1	ค่าพารามิเตอร์แสดงความหยาบบน <mark>พื้</mark> นผิวแบ <mark>บ</mark> 2 และ 3 มิติ <u></u>	47
4.2	ขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้ว <mark>ยแส</mark> ง	67
4.3	แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	104



สารบัญรูป

รูปที่

2.1	กระบวนการดูดซับที่เกิดขึ้นภายในรูพรุนของสารดูดซับ	6
2.2	ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี	7
2.3	กระบวนการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไล <mark>ซิส</mark> บนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา	8
2.4	โครงสร้างผลึกของ TiO ₂	_11
3.1	ภาพรวมวิธีการดำเนินการวิจัย	17
3.2	เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสต้นแ <mark>บ</mark> บที่ 1 <mark></mark>	_20
3.3	ภาพรวมการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริย <mark>าด้ว</mark> ยแสงแ <mark>ล</mark> ะการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาลงบนแผ่น	
	ตะแกรงสแตนเลสชนิ 3105	<u>_</u> 21
3.4	ลักษณะแผ่นตะแกรงสแตน <mark>เลส</mark> ชนิด 3105	<u>_</u> 23
3.5	เครื่องจุ่มเคลือบที่ใช้ในการ <mark>ทด</mark> ลอง	<u>2</u> 3
3.6	แผ่นกรองความชื้นและอากาศ	<u>.</u> 29
3.7	้ เครื่องปฏิกรณ์โฟโต <mark>คะ</mark> ตะไ <mark>ลซิสต้นแบบที่ 2 แบบอนุ</mark> กรม <mark>2 แ</mark> ละ 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา	<u>.</u> 30
3.8	รูปแบบการทดสอบการฆ่าเชื้อแบบที่ 1	.34
3.9	ตำแหน่งการหยิบ <mark>สุ่มตัวอย่างชั่วโมงละ 3 ตัวอย่าง กรณีปราศจ</mark> ากแผ่นกรองอากาศ	<u>.</u> 35
3.10	ตำแหน่งการหยิบสุ่มตัวอย่า <mark>งชั่วโมงละ 3 ตัวอย่าง กรณีมีแผ่</mark> นกรองอากาศ <u></u>	<u>.</u> 36
4.1	ขั้นตอนการทำบริสุทธิ์ SiO ₂ แ <mark>ละการเกิดโครงสร้างรู</mark> พรุนบนพื้นผิว SiO ₂	<u>41</u>
4.2	ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาค FESEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ละชนิด	<u>42</u>
4.3	รูปแบบ XRD แสดงโครงสร้างเฟสและผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด	<u>43</u>
4.4	ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาค EDS เพื่อแสดงตำแหน่งของธาตุและองค์ประกอบธาตุในตัวเร่ง	
	ปฏิกิริยาแต่ละชนิด	_44
4.5	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ของพื้นผิวแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ก่อนทำการเคลือบ	
	ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กำลังขยายขนาดต่าง ๆ	.45
4.6	ลักษณะความหยาบของพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ	<u>47</u>
4.7	ลักษณะความหนาของชั้นฟิล์มหลังเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา	_48
4.8	ลักษณะพื้นผิวที่วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) หลังทำการ	
	เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO ₂ และ TiO ₂ /SiO ₂ บนแผ่นตะแกรงสแตนเลส 3105	<u>49</u>
4.9	การทดสอบความคงที่ของเครื่องปฏิกรณ์ในการสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂	<u>.</u> 50

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.10	ผลกระทบขององค์ประกอบสำคัญในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส	52
4.11	การจำลองกลไกการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H2O2 ร่วมกับ	
	ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO ₂ /SiO ₂	<u>.</u> 53
4.12	ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ ด้วยกระบวนการ	
	โฟโตคะตะไลซิส	54
4.13	จำลองกลไกการดูดซับโมเลกุลของน้ำที่ <mark>คว</mark> ามชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่แตกต่างกันโดยที่	
	โมเลกุลอิสระของน้ำถูกดูดซับเป็นจ <mark>ำนวนมา</mark> กบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา	55
4.14	ผลกระทบของความเร็วของอากาศส <mark>ำ</mark> หรับสั <mark>ง</mark> เคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂	56
4.15	ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ในอ <mark>า</mark> กาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂	<u></u> 58
4.16	ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ <mark>ในอ</mark> ากาศสำห <mark>รับ</mark> สังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ ด้วยกระบวนการ	
	โฟโตคะตะไลซิสเมื่อพิจารณ <mark>าช่ว</mark> งเวลาที่แตกต่างกั <mark>น</mark>	59
4.17	กลไกของผลกระทบจากค <mark>วาม</mark> ชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ <mark>สำห</mark> รับสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂	60
4.18	ผลกระทบของความเร็วของอากาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂	62
4.19	ผลกระทบของขนา <mark>ดอนุ</mark> ภา <mark>ค SiO₂ สำหรับสังเคราะห์ก</mark> ๊าซ <mark>H₂O₂</mark>	<u></u> 63
4.20	ผลกระทบของสัด <mark>ส่วน</mark> ระหว่าง TiO ₂ และ SiO ₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO ₂ /SiO ₂ สำหรับ	
	สังเคราะห์ก๊าซ H ₂ O ₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส	65
4.21	รูปแบบ XRD แสดงโ <mark>ครงสร้างเฟสและผลึกของตัวเร่งป</mark> ฏิกิริยาด้วยแสง <u>.</u>	67
4.22	รูปแบบโครงสร้างเฟสผลึก 3 มิติขอ <mark>งตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย</mark> แสง	68
4.23	การวิเคราะห์ทางพื้นผิวโดยวิธี BET surface area ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแต่ละชนิด	71
4.24	ไอโซเทิร์มการดูดซับและการคายซับของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแต่ละชนิด	72
4.25	ค่าการดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ปริมาณ SiO ₂ แตกต่างกัน	73
4.26	ค่าพลังงานแถบช่องว่างของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ปริมาณ SiO ₂ แตกต่างกัน	73
4.27	แนวความคิดของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/SiO2 โครงสร้างเฟสผสมระหว่างรูไทล์และอนาเทส	
	ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส	75
4.28	การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงด้วยเทคนิค FTIR	76
4.29	ภาพถ่าย SEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ช่วงขนาดอนุภาค SiO ₂ แตกต่างกัน	78
4.30	ภาพถ่าย SEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สัดส่วนของ SiO ₂ แตกต่างกัน	79
4.31	ลักษณะความหยาบของพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วงขนาด	
	อนุภาค SiO ₂ แตกต่างกัน	80

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.32	ลักษณะความหยาบของพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สัดส่วนของ	
	SiO ₂ แตกต่างกัน	<u> 81 </u>
4.33	ลักษณะความหนาของชั้นฟิล์มหลังเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ช่วงขนาดอนุภาค SiO_2	
	แตกต่างกัน	<u>.</u> 82
4.34	ลักษณะความหนาของชั้นฟิล์มหลังเคลื <mark>อบ</mark> ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สัดส่วนของ SiO ₂	
	แตกต่างกัน	<u>.</u> 83
4.35	ความแตกต่างระหว่างบริเวณพื้นผิวที <mark>่เคลือบ</mark> ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและพื้นผิวชิ้นงาน	
	ตัวอย่างของแผ่นสแตนเลส 3105	84
4.36	สเปกตรัม EPR แสดงการตอบส <mark>นอง</mark> ต่ออิเล็ก <mark>ต</mark> รอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	<u>.</u> 85
4.37	การทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ <mark>H₂O</mark> 2 ที่สภาว <mark>ะเดี</mark> ยวกันจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แผ่น	
	โดยปราศจากการติดตั้งชุด <mark>กรอ</mark> งอากา <mark>ศร่วม</mark> กับเครื <mark>่อง</mark> ปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส	. 87
4.38	การทดสอบการสังเคราะ <mark>ห์ก๊าซ</mark> H ₂ O ₂ ที่สภาวะเดีย <mark>วกัน</mark> โดยปราศจากการติดตั้งชุดกรอง	
	อากาศร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสที่การต่อเครื่องปฏิกรณ์แบบอนุกรม	
	แตกต่างกัน	<u>.</u> 88
4.39	เปรียบเทียบเครื่อ <mark>งปฏิ</mark> กรณ์ <mark>แบบอนุกรม</mark> 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยาที่มีแผ่นกรองและไม่มี	
	แผ่นกรองอากาศร่ <mark>วมกับชุดเค</mark> รื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส	.89
4.40	การตรวจสอบการก <mark>ระจายตัวและการมีอยู่ของก๊าซ H₂O₂ ใน</mark> ห้องทดสอบการฆ่าเชื้อด้วย	
	แผ่นวัดก๊าซ H ₂ O ₂ ที่ตำแหน่งแตกต่างกัน	.90
4.41	การทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli โดยปราศจากชุดกรองอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ในอาการ	ฬ
	ร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส	<u>.</u> 93
4.42	การทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli โดยมีชุดกรองอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับ	
	เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส	<u>94</u>
4.43	การทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli โดยมีชุดกรองอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับ	
	เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสที่ระนาบการวางจานอาหารเลี้ยงเชื้อแตกต่างกัน	<u>.</u> 95
4.44	การทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli โดยมีชุดกรองอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับ	
	เครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิสที่สำหรับห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ และบริเวณที่ไม่มีการฆ่า	
	เชื้อด้วยก๊าซ H ₂ O ₂	<u>.</u> 94
4.45	ผลการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวขนมปัง	<u>.</u> 97
4.46	ผลการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวหัวหอมแดง	.98

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.47	ผลการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแอปเปิ้ล	
4.48	ผลการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวถั่วลันเตา	



บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของปัญหา

การดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้ถูกพัฒนาและแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังสถานการณ์ในปัจจุบันประชากรกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของเชื้อจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค "โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)" การติดเชื้อจากจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Smith, 1977) เนื่องจากเชื้อโรคเหล่านี้สามารถพบได้ทั่วไปใน สิ่งแวดล้อม การฆ่าเชื้อมีทั้งวิธีทางกายภาพและทางเคมี (McKeen, 2012) แต่ข้อจำกัดของวิธีการ ต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ

กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสสามารถผลิตสารออกซิไดซ์เพื่อทำลายเซลล์ของเชื้อโรค ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ หากกล่าวถึง ความปลอดภัยของ H₂O₂ สามารถพบได้ทั่วไปในอาหาร น้ำดื่ม น้ำฝน หรือน้ำทะเล (Willey, 1999; Price, 1992; Szymczak, 1991; Weller, 1993) ในระบบร่างกายของมนุษย์ยังค้นพบว่าสามารถ สังเคราะห์ H₂O₂ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในร่างกาย (Halliwell, 2000) ลักษณะทางกายภาพของ H₂O₂ ในรูปแบบก๊าซพบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคได้ดีกว่าในรูปของสารละลาย เนื่องจากคุณสมบัติ ในรูปของก๊าซ H₂O₂ สามารถกระจายตัวได้ดีและเข้าถึงพื้นผิวต่าง ๆ ได้ง่าย สามารถเข้าจับกับเซลล์ และเกิดการฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความไม่เสถียรทางโครงสร้างเคมี H₂O₂ จะแตกตัวเป็นน้ำและ ออกซิเจน ดังนั้นจึงลดความน่ากังวลเกี่ยวกับการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานบริหารความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) แนะนำระดับของ H₂O₂ ที่ระเหยกลายเป็นไอต่ำกว่า 1.0 ppm (1.4 mg/m³) เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่

งานวิจัยทางด้านโฟโตคะตะไลซิสส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการออกซิเดซันเพื่อสร้าง H_2O_2 เป็นสารออกซิไดซ์ (Finnegan, 2010) มีการรายงานตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพ หลายชนิด อาทิเช่น TiO_2 ZnO SnO_2 WO_3 CdS ZrO_2 Sb_2O_4 และ Fe_2O_3 โดยที่ TiO_2 ได้รับความ สนใจอย่างมาก เนื่องจากมีความเสถียรภายใต้แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลตและราคาถูกเมื่อเทียบ กับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะอื่น ๆ (James, 2019) มีการกล่าวถึงประสิทธิภาพของการใช้ TiO_2 อย่างเดียว ได้รับผลกระทบในการดักจับอิเล็กตรอนและโฮลบนพื้นผิวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ เกิดปฏิกิริยาบนพื้นผิว ดังนั้น TiO_ จึงได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางโดยการเติมอนุภาคโลหะบาง ชนิด เช่น Au Ag Pt เป็นต้น แนวโน้มการศึกษาพบว่าการเพิ่มอนุภาคโลหะเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่มี ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ H_2O_2 (Hou, 2020) ในรูปแบบสารละลาย แต่ถึงแม้จะมีโลหะบางชนิดมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการนำไปใช้งานในกระบวนการผลิตจริง เนื่องจากส่งผลต่อราคาต้นทุนกระบวนการผลิต ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและมีความยั่งยืน

จึงเป็นที่น่าสนใจในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับ TiO₂ ประกอบกับประเทศไทยประกอบอาชีพ เกษตรกรรมซึ่งแกลบเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตข้าวอุดมไปด้วยซิลิกา (SiO₂) จำนวนมาก มีการศึกษามุ่งเน้นไปที่การเติม TiO₂ ลงบนพื้นผิวอนุภาค SiO₂ เพื่อสร้างวัสดุคอมโพสิต TiO₂/SiO₂ (Collin, 2021) ถูกใช้งานด้านการกำจัดมลพิษอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ (Bellardita, 2010; รชา นนท์, 2556) นอกจากนั้นการเพิ่ม SiO₂ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวจำเพาะต่อหนึ่งหน่วยมวลของตัวเร่งปฏิกิริยา อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ปรากฏโครงสร้างรูพรุนบนพื้นผิว อีกทั้ง ปรับปรุงแถบช่องว่างพลังงาน TiO₂ โดยก่อโครงสร้างเป็น TiO₂/SiO₂ เพื่อสร้างพันธะ Ti–O–Si ช่วยดัก จับอิเล็กตรอนและโฮลบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ลดการกลับมารวมตัวกันของอิเล็กตรอนและ โฮลในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพิ่มหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้นผิวดึงดูดโมเลกุลชอง O₂ และ H₂O ไปยังศูนย์กลางโฟโตแอกทีฟของ TiO₂ ส่งผลให้อัตราการย่อยสลายโมเลกุลสารตั้งต้นและกลายเป็น สารผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แหล่งกำเนิดแสง มีงานวิจัยหลายฉบับยืนยันประสิทธิภาพ ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ พบประสิทธิภาพในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส มากกว่า การใช้ TiO₂ เพียงอย่างเดียวสำหรับสังเคราะห์ H₂O₂ ในรูปสารละลายและก๊าซ (Tanongsak, 2022; Collin, 2021; Hou, 2020)

การยกระดับองค์ความรู้ในงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในปัจจุบันมีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากการมีองค์ความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง สามารถต่อยอดเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้มีความประสงค์สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ สังเคราะห์ H₂O₂ ในรูปก๊าซแห้งจากความขึ้นสัมพัทธ์ในอากาศผ่านกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาการติดเชื้อบนพื้นผิวโดยองค์ความรู้นี้จะเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อาทิเช่น การใช้งานด้านการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวที่ไม่ต้องการทำลายพื้นผิวหลังการใช้งาน การพัฒนาเป็น เครื่องฟอกอากาศด้วยก๊าซ H₂O₂ รวมถึงการพัฒนาเป็นเครื่องฆ่าเชื้อส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้ สะดวกหรือการใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ต้องการความแห้งบนพื้นผิว เป็นพิเศษ ไม่ต้องการกลิ่น และรสปนเปื้อนหลังจากฆ่าเชื้อโรค การใช้งานทางด้านการแพทย์หรือการ ฆ่าเชื้อในระดับอุตสาหกรรม สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษานี้จะเป็นองค์ความรู้สำหรับ ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสสำหรับระบบก๊าซเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรม ใหม่ ๆ ในอนาคตได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 สร้างเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสสำหรับระบบก๊าซและทดสอบความเป็นไปได้ ของงานวิจัย

1.2.2 เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศด้วยเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสสำหรับระบบก๊าซ

1.2.3 เพื่อศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ สำหรับกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิส 1.2.4 เพื่อทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ในห้องจำลองปริมาตร
 0.027 m³ ร่วมกับการทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอาหาร

1.2.5 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ ที่ได้จากองค์ความรู้ ในงานวิจัย

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

กลไกของร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์ H₂O₂ โดยการเปลี่ยนความชื้นและออกซิเจน ภายในปอดด้วยเอนไซม์ให้กลายเป็น H₂O₂ การลอกเลียนแบบกลไกเหล่านี้สามารถประยุกต์ผ่าน กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเพื่อการสังเครา<mark>ะห์</mark> H₂O₂ ในรูปแบบก๊าซจากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ด้วยคุณสมบัติของ SiO₂ สามารถดูดซับความชื้นได้เป็นอย่างดี

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

1.4.1 เตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) ตามสภาวะการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดในงานวิจัยของ รชานนท์ กลอนดอน (2556)

1.4.2 ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ใช้ศึกษาในงานวิจัย ได้แก่ TiO₂ และ SiO₂ เพื่อสร้างวัสดุ คอมโพสิต TiO₂/SiO₂

1.4.3 ความชื้นสัมพั<mark>ท</mark>ธ์ในอากาศถูกใช้เป็นสารตั้งต้<mark>น</mark>สำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂

1.4.4 เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ด้วยวิธีโซล-เจล และใช้วิธีจุ่ม
 เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาลงบนวัสดุรองรับ

1.4.5 วัสดุรอ<mark>งรับตัว</mark>เร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในงานวิจัยคือแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S

1.4.6 ศึกษาการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ในห้องจำลองปริมาตร 0.027 m³

1.4.7 ทดสอบการ<mark>ฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂ จากสภา</mark>วะการสังเคราะห์ที่ดีที่สุดกับเชื้อ Escherichia coli (E. coli) และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอาหาร ได้แก่ ขนมปัง แอบเปิ้ล หัวหอมแดง และ ถั่วลันเตา

1.4.8 ประเมินแผนธุรกิจเบื้องต้นของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ โดยการทำ Business Model Canvas (BMC)

บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทของปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอเนื้อหาและข้อมูลที่ครอบคลุม หัวข้องานวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 4 หัวข้อดังต่อไปนี้ ส่วนแรกแนวความคิดการสังเคราะห์ H₂O₂ จากกลไกร่างกายของมนุษย์ ส่วนที่สองพื้นฐานของกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ส่วนที่สามบทบาท ของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ สำหรับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ส่วนสุดท้าย การประยุกต์ใช้กระบวนการโฟโตคะตะไลซิ<mark>สร่วมกับ</mark>การกำจัดเชื้อจุลซีพ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

2.1 แนวความคิดการสังเคราะห์ H₂O₂ จ<mark>า</mark>กกลไกร่างกายของมนุษย์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) เป็นของเหลวโควาเลนต์ผสมกับน้ำได้อย่างอิสระ เมื่อระดับ ความเข้มข้นของ H₂O₂ สูงกว่า 50 μM จะส่งผลกระทบต่อเซลล์พืช สัตว์ แบคทีเรีย แม้ว่าระดับความ เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์อยู่ที่ค่า LD₅₀ ก่อให้เกิดการตายของเซลล์ แต่อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยเข้า มาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ชนิดของเซลล์ สถานะทางสรีระวิทยา ระยะเวลาในการสัมผัสกับ H₂O₂ ความ เข้มข้นของ H₂O₂ (Halliwell et al, 2000) ด้วยเหตุนี้ H₂O₂ จึงถูกกล่าวว่าเป็นพิษอย่างมากใน ร่างกายต้องถูกกำจัดอย่างรวดเร็วเมื่อระดับความเข้มข้นสูงกว่าที่ร่างกายมนุษย์ยอมรับได้โดยใช้เอม ไซม์ ได้แก่ คะตาเลส เพอร์ออกซิเดส และสารต้านอนุมูลอิสระ (Halliwell, 1999; Chance, 1979; Matsumoto, 1999; Takagi, 1999; Bai, 1999) ในทางเคมีกล่าวถึง H₂O₂ มีปฏิกิริยาได้ไม่ดีทำหน้าที่ เป็นตัวออกซิไดซ์อย่างอ่อนหรือตัวรีดิวซ์เพียงเล็กน้อย แต่ไม่ได้ออกซิไดซ์โมเลกุลทางชีววิทยาได้อย่าง รวดเร็ว อาทิเช่น ลิพิด ดีเอ็นเอ และโปรตีน ความเสียหายของเซลล์จาก H₂O₂ ส่วนใหญ่มาจากการ แปลงสภาพ H₂O₂ ไปเป็นไฮดรอกซิลเรดิคัลที่ทำปฏิกิริยาได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเกิดจากการสัมผัสของ H₂O₂ กับแสงอัลตราไวโอเลต (Halliwell, 2000; Ueda, 1996) อย่างไรก็ตามระดับความเข้มข้นของ H₂O₂ ประมาณ 20 ถึง 50 μM หรือต่ำกว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์ได้จำกัดในเซลล์หลายซนิด

การสังเคราะห์ H₂O₂ ในร่างกายมนุษย์มาจากการเปลี่ยนรูปซูเปอร์ออกไซด์เรดิคัลทั้งแบบที่ ใช้เอนไซม์และไม่ใช้เอนไซม์ H₂O₂ ยังสามารถผลิตได้โดยตรงจากเอนไซม์ออกซิเดสหลายชนิด ดังนั้น เซลล์ของมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีระดับความเข้มข้นของ H₂O₂ โดยพิจารณาที่ไมโตคอนเดรียเป็นปัจจัย สำคัญ เนื้อเยื่อบางชนิดในร่างกายมนุษย์อาจสัมผัสกับความเข้มข้นของ H₂O₂ ได้ในระดับที่สูง ยกตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มที่มนุษย์ดื่มหลายชนิดมีระดับความเข้มข้นของ H₂O₂ สูงถึง 100 µM ได้แก่ ชาเขียว ชาดำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกาแฟสำเร็จรูป (Long, 1999; Fujita, 1985; Hiramoto, 1998) เมื่อเครื่องดื่มเหล่านี้ถูกบริโภคเข้าไป H₂O₂ ที่มีอยู่ในนั้นจะเข้าสู่เซลล์ทางเดินอาหารอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นเชื้อแบคทีเรียในช่องปากยังผลิต H₂O₂ ในน้ำลายเปอร์ออกซิเดสเพื่อออกซิไดซ์ทำลาย

แบคทีเรียบางชนิด หากกล่าวถึงเซลล์ที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจมีความคล้ายคลึงกับเซลล์เยื่อบุใน ช่องปากและหลอดหารจะมีความเข้มข้นของ O₂ สูง (21%) เมื่อเทียบกับเนื้อเยื่ออื่น ๆ มากไปกว่านั้น H₂O₂ ถูกค้นพบการมีอยู่ทั่วไปในอากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไป (Halliwell, 2000) ปริมาณของ H₂O₂ ้ที่หายใจออกจะพบมากในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังและคนสูบบุหรี่ แต่อย่างไรก็ตาม H₂O₂ ยังสามารถพบ ในอากาศที่หายใจออกของมนุษย์ที่มีสุขภาพดี การค้นพบระดับความเข้มข้นของ H₂O₂ บางครั้งสูงถึง 100 µM สามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะของมนุษย์ ระดับความเข้มข้นของ H₂O₂ ในร่างกายจึงถูก ้ควบคุมโดยเอนไซม์คะตาเลส H₂O₂ ในกระเพาะปัสสาวะถูกสร้างขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียส่วนระดับ ้ความเข้มข้นของ H₂O₂ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางอาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไป งานวิจัยบาง ้งานวิจัยอ้างว่ามี H₂O₂ ในปริมาณมาก (มา<mark>กก</mark>ว่า 35 µM) ในเลือดของมนุษย์ (Halliwell, 2000) แต่บางงานวิจัยก็อ้างว่าต่ำมากหรือเข้าใกล้ศูนย์ (Frei et al, 1988) จากการศึกษาข้อมูลภายหลัง ้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นส่วนหนึ่งของการ<mark>ศึกษาบ่</mark>งบอกว่าปริมาณ H₂O₂ ที่ลดลงในหลอดเลือดของ ้มนุยษ์เสื่อมสลายไปเพราะว่าการมีอยู่ของเ<mark>อ</mark>นไซม์<mark>ค</mark>ะตาเลส H₂O₂ สามารถทำปฏิกิริยากับกลุ่มโปรตีน ในร่างกาย รวมถึง H₂O₂ ที่สร้างขึ้นในพล<mark>า</mark>สมาสา<mark>ม</mark>ารถควบคุมระดับของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ี เซลล์ผนังหลอดเลือด และเกล็ดเลือด<mark>เพื่</mark>อการเผา<mark>ผลา</mark>ญ การมีอยู่ของ H₂O₂ ในระดับความเข้มข้น ้ต่าง ๆ สามารถพบได้ทั่วไปในร่างกายของมนุษย์ <mark>แม้แต่</mark>ของเหลวในดวงตายังสร้าง H₂O₂ อย่าง ต่อเนื่องและถูกกำจัดออกอย่างร<mark>วดเ</mark>ร็ว ดังนั้นชี้ให้เห็นว่<mark>าระบ</mark>บร่างกายของมนุษย์มีทั้งการสังเคราะห์ H₂O₂ และการขับ H₂O₂ ออกจากร่างกายผ่านทางระบบหายใจหรือระบบขับถ่าย ถึงแม้ว่า H₂O₂ ้จะเป็นพิษต่อเซลล์หลายชน<mark>ิ</mark>ด การควบคุมปริมาณความเข้ม<mark>ข้</mark>นของ H₂O₂ ได้อย่างเหมาะสมจะ ้สามารถประยุกต์การใช้ง<mark>าน</mark> H₂O₂ ตามคุณสมบัติของสารในการ<mark>ฆ่าเ</mark>ชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพใน ขอบเขตที่ร่างกายของมนุษย์ยอมรับได้

2.2 พื้นฐานของกระบวนกา<mark>รโฟโตคะตะไลซิ</mark>ส

กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เป็นกระบวนการที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นสารกึ่งตัวนำที่ใช้ พลังงานแสงเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยตัวเร่งปฏิกิริยานี้ เรียกว่า "โฟโตคะตะลิสต์" ซึ่งเป็นคำที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ "โฟโต (photo)" ส่วนใหญ่ใช้นำหน้าคำที่ แสงเข้ามาเกี่ยวข้อง และ "คะตะลิสต์ (catalyst)" หมายถึง วัสดุหรือสารประกอบซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะอยู่ในรูปของผงหรือฟิล์ม กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพใน การกำจัดสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำหรืออากาศ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อยสอง กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการดูดซับบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการเกิดปฏิกิริยา โฟโตคะตะไลซิสบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

10

2.2.1 กระบวนการดูดซับบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา

การดึงดูดโมเลกุลของเหลวหรือก๊าซให้มายึดเกาะหรือติดบริเวณพื้นผิวของของแข็ง เรียกกระบวนการเหล่านี้ว่า กระบวนการดูดซับ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสกระบวนการดูดซับ จะเกี่ยวข้องกับการดูดซับสารเพื่อเกิดปฏิกิริยาบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้แหล่งกำเนิดแสง โดยทั่วไปการยึดเกาะของโมเลกุลของสารบริเวณพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้จากแรงกระทำ ระหว่างโมเลกุลของสารดูดซับและสารถูกดูดซับ เป็นแรงดึงดูดอย่างอ่อนที่เรียกว่า แรงแวนเดอร์วาลส์ จัดเป็นการดูดซับทางกายภาพหรืออาจเกิดจากการสร้างพันธะเคมีที่มีความแข็งแรงกว่า ซึ่งจัดเป็น การดูดซับทางเคมี ความแตกต่างของการดูดซับทางกายภาพและทางเคมี ดังแสดงในรูปที่ 2.2 เนื่อง จากการดูดซับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นคุณสมบัติเบื้องต้นของสารดูด ซับที่ดีต้องสามารถดูดซับสารต่อหน่วยน้ำหนักหรือต่อหน่วยปริมาตรได้มาก กลไกการดูดซับโมเลกุล ของสาร ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ภาพรวมของกระบวนการดูดซับสารโดยในขั้นตอนแรกเป็นการถ่ายโอน มวลของโมเลกุลสารถูกดูดซับจากวัฏภาคของไหลไปยังพื้นผิวภายนอกของอนุภาคสารดูดซับ (รูปที่ 2.1(ก)) หลังจากนั้นโมเลกุลของสารถูกดูดซับจะแพร่เข้าไปภายในอนุภาคของสารดูดซับซึ่งประกอบ ด้วยการแพร่กระจายในช่องว่างของรูพรุน (รูปที่ 2.1(ข)) และการแพร่ไปบนพื้นผิวภายในรูพรุน (รูปที่ 2.1(ค)) ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการดูดซับบนตำแหน่งที่เหมาะสมบนพื้นผิว (รูปที่ 2.1(ง)) สำหรับ ปรากฏการณ์ที่เกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับกระบวนการดูดซับเรียกว่ากระบวนการคายซับซึ่งเป็น กระบวนการที่ทำให้โมเลกุลของสารถูกดูดซับหลุดออกจากตำแหน่งการดูดซับ (ชัยยศ, 2554)



รูปที่ 2.1 กระบวนการดูดซับที่เกิดขึ้นภายในรูพรุนของสารดูดซับ (ก) การแพร่ของโมเลกุลไปยังพื้นผิว ภายนอกของอนุภาคดูดซับ; (ข) การแพร่ภายในช่องว่างรูพรุน; (ค) การแพร่บนพื้นผิวภายใน และ (ง) บริเวณชั้นดูดซับ



รูปที่ 2.2 ความแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี

2.2.2 กระบวนการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา

กระบวนการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสจะเกิดขึ้นเมื่อสารถูกดูดติดบริเวณพื้นผิว ของตัวเร่งปฏิกิริยาและมีการฉายแสงจากแหล่งกำเนิดแสงหรือหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (สุเมธ, 2550) ไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา พลังงานแสง (hv) ที่มากกว่าหรือเท่ากับพลังงานของแถบซ่องว่างพลังงาน (energy band gab; E_g) ตัวเร่งปฏิกิริยาจะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ เรียกว่า แถบวาเลนซ์หรือวาเลนส์แบนด์ (valence band; VB) ให้ถ่ายโอนไปยังแถบนำไฟฟ้าหรือ คอนดักชันแบนด์ (conduction band; CB) ดังแสดงรูปที่ 2.3 ทำให้เกิดคู่อิเล็กตรอน (e^-) และโฮล (h^+) ในตัวเร่งปฏิกิริยาโดยที่เกิดโฮลหรือประจุบวก h_{VB}^+ ที่ชั้นวาเลนส์แบนด์ ส่วนชั้นคอนดักชัน แบนด์เกิดอิเล็กตรอนหรือประจุลบ e_{CB}^- ดังสมการ 2.1 เพื่อทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันกับ โมเลกุลของน้ำ (H₂O) และออกซิเจน (O₂) ดังแสดงรายละเอียดของการเกิดปฏิกิริยาในสมการที่ 2.2-2.6 (Yang, 2006) ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.3 กระบวนการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา

$$TiO_2 + hv \rightarrow TiO_2(h_{VB}^+ + e_{CB}^-)$$
(2.1)

โฮล (h^+) จากชั้นวาแลนซ์แบนสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอินทรีย์และไอออนต่าง ๆ ดังนี้

$$OH_{ads}^{-} + h_{VB}^{+} \to OH_{ads}^{\bullet}$$
(2.2)

$$H_2O + h_{VB}^+ \to OH_{ads}^\bullet + H^+ \tag{2.3}$$

โดยที่ไฮดรอกซิลเรดิคอล (OH^{ullet}) ที่เกิดขึ้นจะไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ ส่วน e^-_{CB} ในชั้น คอนดักชันแบนด์จะทำปฏิกิริยารีดักชันกับ O_2 ที่มีอยู่ในระบบได้ประจุลบของซูเปอร์ออกไซด์ O^-_2

$$O_{2(ads)} + e_{CB}^{-} \rightarrow O_{2(ads)}^{-} \tag{2.4}$$

จากนั้นประจุลบของ O_2^- จะทำปฏิกิริยากับ H_2O เกิดเป็น H_2O_2 ดังสมการ

$$2O_2^- + H_2O \to H_2O_2 + 2OH^- + O_2$$
(2.5)

จากสมการที่ 2.5 โมเลกุลของ H_2O_2 ที่ได้จะทำปฏิกิริยาต่อกับ e^- ที่ชั้นคอนดักชันแบนด์เกิดเป็น OH^{ullet} และ OH^- ดังนี้

$$H_2O_2 + e_{VB}^- \to OH^- + OH^{\bullet}$$
(2.6)

2.2.3 องค์ประกอบส<mark>ำคัญ</mark>ในกร<mark>ะบวนการโฟโตค</mark>ะตะไลซิส

หัวข้อนี้จะแสดงองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส อาทิ เช่น แหล่งกำเนิดแสง ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ปัจจัยภายนอกและภายในที่ต้องคำนึงถึงใน กระบวนการโฟโตคะตะไ<mark>ลซิส</mark> ซึ่ง<mark>รายละเอียดได้อธิบายไว้ใน</mark>หัวข้อ<mark>ดัง</mark>ต่อไปนี้

2.2.3.1 แหล่งกำเนิดแสง

ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงหรือตัวเร่งปฏิกิริยาที่กระตุ้นด้วยแสง เป็นวัสดุ จำพวกกึ่งตัวนำทำหน้าที่คล้ายคลึงกับคลอโรฟิลล์ในพืชสีเขียวที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ สังเคราะห์แสงของพืช โดยการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นแป้งและออกซิเจน สำหรับ ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพื่อเปลี่ยนสารอินทรีย์และ อนินทรีย์ที่เป็นพิษให้กลายเป็นไม่มีพิษหรือมีพิษน้อยลง ดังที่กล่าวในส่วนต้น ปัจจัยสำคัญสำหรับ กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส สิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการนี้คือแหล่งกำเนิดแสงมีบทบาทในการ กระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สามารถปลดปล่อยอิเล็กตรอนและโฮลเพื่อทำปฏิกิริยาบนพื้นผิว โดยที่ พลังงานแสงจะต้องมีค่าพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าพลังงานของแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่ง ปฏิกิริยาซึ่งสามารถจำแนกแสงตามช่วงความยาวคลื่น (Venturini, 2009) ได้ดังนี้

อัลตราไวโอเลต (ultraviolet; UV)	100-400 นาโนเมตร
ยูวีวี (ultraviolet vacuum; UV-V)	100-200 นาโนเมตร
ยูวีซี (ultraviolet C; UV-C)	200-280 นาโนเมตร
ยูวีบี (ultraviolet B; UV-B)	280-315 นาโนเมตร
ยูวีเอ (ultraviolet A; UV-A)	315-400 นาโนเมตร

แสงที่มองเห็น (visible light)	400-780 นาโนเมตร
อินฟราเรด (infrared)	780-1000 นาโนเมตร

้ความสัมพันธ์ของพลังงานโปรตอนกับความยาวคลื่นสามารถคำนวณได้จากสมการดังต่อไปนี้

$$E = hv = \frac{hc}{\lambda} \tag{2.7}$$

เมื่อ E คือ พลังงานโฟตอน (photon energy)

h คือ ค่าคงที่ของ Planck (Pl<mark>anc</mark>k's constant) มีค่าเท่ากับ 6.625 x 10⁻³⁴ J·s

- *v* คือ ค่าความถี่ (Hz)
- λ คือ ค่าความยาวคลื่น (nm)

c คือ ค่าความเร็วแสง มีค่าเท่ากับ <mark>3</mark> × 10⁸ m/s

2.2.3.2 วัสดุกึ่งตัว<mark>น้ำห</mark>รือตัวเร่งป<mark>ฏิกิริยา</mark>ด้วยแสง

วัสดุกึ่งตัวนำเป็นธาตุอย่างหนึ่ง ซึ่งในธาตุทุกชนิดจะประกอบไปด้วยอะตอม โดยที่ภายนอกอะตอมของธาตุเหล่านี้ประกอบไปด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โปรตอนกับ นิวตรอนจะอยู่ภายในนิวเคลียส ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอะตอมและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก คล้าย ๆ กับวงโคจรในระบบสุริยะ โดยที่อิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรใกล้กับนิวเคลียสจะมีระดับ พลังงานต่ำเนื่องจากนิวเคลียสสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนเหล่านี้ได้ ขณะที่อิเล็กตรอนที่โคจรรอบ นิวเคลียสที่อยู่ห่างไกลออกไปจะมีระดับพลังงานสูง และพร้อมที่จะเคลื่อนที่อย่างอิสระถ้าได้รับ พลังงานกระตุ้นจากภายนอกอย่างเพียงพอ อิเล็กตรอนในวงโคจรวงนอกสุดของอะตอมนั้น ๆ เรียกว่า วาเลนซ์อิเล็กตรอน ในปัจจุบันวัสดุกึ่งตัวนำที่สามารถนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการ สังเคราะห์ H₂O₂ ด้วยกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิส อาทิเช่น TiO₂ TiO₂/WO₃/rGO Zn²⁺/TiO₂ AuAg/TiO₂ Pt/TiO₂ และ Si/TiO₂-Au เป็นต้น (Hou, 2020)

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) จัดว่าเป็นสารกึ่งตัวนำและเป็นสารประกอบ ออกไซด์ของโลหะไทเทเนียมซึ่งอยู่ในกลุ่มทรานซิชัน TiO₂ มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคในน้ำหรืออากาศได้ ในรูปอนุภาคนาโน โดยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต (Fujishima, 2008; Kim, 2005; Yang, 2006) ไปยังอนุภาค TiO₂ อีกทั้ง TiO₂ เป็นวัสดุที่ราคาไม่แพงมากให้ประสิทธิภาพสูงและมีความเสถียรทาง เคมีในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (ชุติมา, 2554) พื้นผิวของ TiO₂ มีสมบัติชอบน้ำ (hydrophilicity) สมบัติชอบน้ำนี้สามารถนำไปประยุกต์ในด้านการทำความสะอาดตัวเอง (self-cleaning) ตัวอย่างเช่น การทำความสะอาดตัวเองของกระเบื้องหรือการป้องกันหมอกจับกระจกรถยนต์ในช่วงอากาศเย็น (Kanai, 2004) มากไปกว่านั้นยังมีอายุการใช้งานที่คงทน สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ให้ ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับของใหม่ แต่ข้อเสียเปรียบของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงไม่สามารถดูดจับ สารอินทรีย์หรือมลพิษต่าง ๆ ในน้ำหรืออากาศได้ เว้นแต่ว่าสารเหล่านั้นจะมาเกาะติดที่พื้นผิวของสาร เร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ไม่สามารถทำงานได้หากปราศจากแสงในการกระตุ้น (สุเมธ, 2550) มีนักวิจัย หลายท่านได้ทำการศึกษาและพัฒนาตัวดูดซับ เช่น เคลือบ TiO₂ บนผิวของถ่านกัมมันต์เพื่อปรับปรุง ข้อบกพร่องดังกล่าว โดยวัสดุเหล่านั้นจะมีบทบาทในการดูดซับสารอินทรีย์ในสภาวะที่มีแสงและไม่มี แสงอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจะทำการย่อยสลายโมเลกุลสารอินทรีย์และ อนินทรีย์เมื่อได้รับพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสง โดยทั่วไปโครงสร้างผลึก TiO₂ สามารถจำแนกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ อนาเทส รูไทล์ และบรูคไคท์ ดังแสดงในรูปที่ 2.4 โครงสร้างผลึกของ TiO₂ จะมีผล ต่อค่าพลังงานแถบช่องว่างของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยโครงสร้างที่เหมาะสมในกระบวนการโฟโตคะตะไล ซิสจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระบบน<mark>ั้น</mark> ๆ เป็นหลัก



รูปที่ 2.4 โครงสร้างผลึกของ TiO₂ (Linsebigier, 1995; Crystal structure, online)

2.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

ประสิทธิภาพของกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและภายใน ต่าง ๆ กล่าวคือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก ได้แก่ การควบคุมสภาวะต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความยาวคลื่นแสง ค่าพีเอชของสารละลาย ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น ในส่วน ของปัจจัยภายในกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพและเคมีเกี่ยวข้องกับสมบัติเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ โครงสร้างผลึก ขนาดอนุภาค พื้นที่ผิว ที่มีผลต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดย ปัจจัยภายนอกและภายใน (Andreozzi, 1999) ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ปัจจัย	ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบ
		แสงจะสัมพันธ์กับแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยาในการ
	ความเข้มแสงและ	กระตุ้นให้เกิดคู่อิเล็กตรอนและโฮล ความเข้มแสงที่เหมาะสมใน
	ความยาวคลื่นแสง	การกระตุ้นอาจอยู่ในช่วงแสงอัลตราไวโอเลตหรือช่วงแสงที่
		มองเห็นได้ขึ้นอยู่กับค่าแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยา
		อัตราการเกิดปฏิกิริยาในการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจะเกิดในอัตราที่
	9	ต่ำหากอุณหภูมิในปฏิกิริยาสูงหรือต่ำเกินไป เนื่องจากอัตราการ
	อุณหภูม์	รวมตัวใ <mark>หม่</mark> ของคู่อิเล็กตรอนและโฮล จะเกิดได้อย่างรวดเร็วและ
ภายนอก		กลายเป็น <mark>ค</mark> วามร้อนส่งผลต่อการดูดซับบริเวณพื้นผิวของตัวเร่ง
		ปฏิกิร <mark>ิยาให้ลด</mark> ลง
		มีผล <mark>ต่</mark> อการเ <mark>ป</mark> ลี่ยนค่าประจุบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าพีเอช
	ค่าพีเอช	ที่เป <mark>ลี่</mark> ยนแปล <mark>ง</mark> ไปสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณไฮดรอกไซด์ไอออนที่
		พื้นผ <mark>ิ</mark> วซึ่งมีผลต่ <mark>อก</mark> ารเกิดไฮดรอกซิลเรดิคอล
	ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา	<mark>หาก</mark> มีมากเกินไ <mark>ปจะ</mark> ทำให้แสงที่ส่องผ่านไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาลดลง
		เนื่องจากมีความทึบ <mark>แสง</mark> มากทำให้ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา
		ด้วยแสงลดลง
		โครงสร้างแบบอนาเทสแ <mark>ล</mark> ะรูไทล์จะสัมพันธ์กับค่าแถบช่องว่าง
		พลังงาน 3.2 eV และ 3.0 eV ตามลำดับ โครงสร้างผลึกผสม
		ระหว่างอนาเทสและรูไทล์จะให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูง
		กว่าโครงสร้างผลึกอ <mark>นาเทสหร</mark> ือรูไทล์เพียงอย่างเดียวเพราะว่า
	โครงสร้างผ <mark>ลึก</mark>	<mark>อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดระหว่า</mark> งกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
	C.	<mark>จะถูกส่งผ่านจากโครง</mark> สร้างรูไทล์ไปยังโครงสร้างอนาเทส เนื่องจาก
	150	แถบการนำของโครงสร้างอนาเทสอยู่ในตำแหน่งที่มีพลังงานสูง
ภายใน	181	กว่าแถบการนำของโครงสร้างรูไทล์ประมาณ 0.2 eV ดังนั้นจึง
		สามารถลดอัตราการรวมตัวกันใหม่ของคู่อิเล็กตรอนและโฮลจาก
		การสร้างประจุโดยพลังงานแสง
		ขนาดอนุภาคและพื้นผิวเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความสามารถใน
		การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโนเมตร
	ขนาดอนุภาคและ	จะมีพื้นที่ผิวมาก ซึ่งเป็นข้อดีในการนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
	พื้นที่ผิว	เนื่องจากสารประกอบอินทรีย์จะสามารถดูดซับบนพื้นผิวตัวเร่ง
		ปฏิกิริยาได้ในปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดกระบวนการเร่งปฏิกิริยา
		ด้วยแสงได้ดีกว่าตัวเร่งที่มีพื้นที่ผิวต่ำ

ตารางที่ 2.1 ปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

2.3 บทบาทของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ สำหรับกระบวนการโฟโตคะ ตะไลซิส

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงบทบาทของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในงานวิจัยระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ โดยจะกล่าวถึงบทบาทของ SiO₂ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ทั้งบทบาททางกายภาพและทางเคมี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.3.1 ผลกระทบของ SiO2 ต่อพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/SiO2

บทบาทของ SiO2 ถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือสารเติมแต่งร่วมกับโครงสร้างตาข่าย ของ TiO₂ (Liga, 2013) การเติม SiO₂ ลงไปในตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางสัณฐาน ้วิทยาของ TiO₂ เพิ่มพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเร่<mark>งป</mark>ฏิกิริยา อันเนื่องมาจากความพรุนบนพื้นผิวของ SiO₂ ้ส่งผลให้มีพื้นที่ผิวภายในต่อหนึ่งหน่วยมวลสูง คุณสมบัตินี้ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงและการแพร่กระจาย ้ตัวของโมเลกุลสารตั้งต้นบนพื้นผิวได้สูงขึ้น อีกทั้งยังเกิดการสลายตัวของมลพิษบนพื้นผิวของตัวเร่ง ปฏิกิริยาได้มากขึ้น (Jeon, 2015) ในปัจจุบันการปรับปรุงทางสัณฐานวิทยาของ TiO₂ โดยใช้ SiO₂ ้จากรายงานการวิจัยของ Balachandran (2014<mark>)</mark> รายงานว่าพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา ้เพิ่มขึ้นจาก 65 m²/g สำหรับ TiO₂ เป็<mark>น 7</mark>5 m²/g <mark>สำห</mark>รับ TiO₂/SiO₂ ในขณะที่รูพรุนเฉลี่ยที่คำนวณ ได้จาก BET ไอโซเทิร์มมีค่าเท่ากับ 10 นาโนเมตร สำหรับ TiO₂ และ 15 นาโนเมตรสำหรับ TiO₂/SiO₂ งานวิจัยของ Bellardita (2010) รายงานว่าพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂-Cabot SiO₂ TiO₂-Axim SiO₂ และ TiO₂-Fly Ash SiO₂ มีค่าเท่ากับ 177 49 และ 29 m²/g ตามลำดับ ส่วน รายงานวิจัยของ Fatimah (2015) รายงานว่า TiO2/SiO2 ที่ผลิตโดยใช้เถ้าแกลบเป็นสารตั้งต้นของ SiO₂ มีพื้นที่ผิวจำเพาะเท่ากับ 9<mark>1.91 m²/g เทียบกับตัวเถ้</mark>าแก<mark>ลบ</mark>ที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะ 25.09 m²/g ้มีรายงานการวิจัยพบว่า<mark>การสังเ</mark>คราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ โดยใช้ SiO₂ จากเถ้าแกลบปรากฏ พื้นที่ผิวภายในต่อหนึ่งหน<mark>่วยมวลสูงกว่า การใช้ SiO₂ สังเคราะ</mark>ห์จาก tetraethyl orthosilicate (TEOS) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 <mark>แสดงพื้นที่ผิวจำเพาะ</mark> (BET surface area) และขนาดผลึกของ TiO₂/SiO₂ (Romamoorthy, 2016) ข้อมูลในตารางระบุชัดเจนว่าพื้นที่ผิวของ TiO₂/SiO₂ ที่เพิ่มสูง ขึ้นเกิดจากการเติม SiO2 สามารถสังเคราะห์ได้ง่ายด้วยวิธีโซล-เจล และค้นพบว่า TiO2/SiO2 ที่ ้สังเคราะหีได้มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่และปริมาตรรูพรุนสูง (Ren, 2010; Bahadur, 2012)

2.3.2. ผลกระทบของ SiO_2 ต่อขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO_2/SiO_2

บทบาทของ SiO₂ ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ช่วยลดขนาดอนุภาคโดยรวมของ อนุภาค TiO₂/SiO₂ งานวิจัยของ Balachandran (2014) รายงานว่าการดูดซึมสูงสุดของการดูดกลืน แสงของ TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ วัดจาก UV-Vis spectrophotometer มีค่าเท่ากับ 372 และ 352 นาโนเมตร ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ขนาดของผลึก TiO₂/SiO₂ ลดลงอยู่ในช่วงระหว่าง 9-12 นาโนเมตร เมื่อเทียบกับ TiO₂ ที่ขนาดผลึกเท่ากับ 18 นาโนเมตร นอกจากนี้การใช้ข้อมูลจาก SEM และ TEM จากผลการวิเคราะห์ของ Balachandran (2014) รายงานว่า TiO₂ มีโครงสร้างทาง สัณฐานที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากการรวมตัวของอนุภาคโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 15-20 นาโนเมตร ในขณะเดียวกัน TiO₂/SiO₂ แสดงสัณฐานวิทยาด้วยขนาดอนุภาคเฉลี่ย 7-10 นาโนเมตร สิ่งนี้พิสูจน์ ได้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ที่ถูกเติมด้วย SiO₂ ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กและยังมีพื้นที่ผิวขนาด ใหญ่ต่อหน่วยมวลสูงและขนาดที่ลดลงของอนุภาค TiO₂/SiO₂ ช่วยลดวิถีทางซึ่งอิเล็กตรอนและโฮล ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแสงใช้เพื่อย้ายไปยังไซต์ที่ทำงานของ TiO₂ เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของปฏิกิริยา โดยที่อิเล็กตรอนและโฮลลดอัตราการกลับรวมตัวกันใหม่ ดังนั้น TiO₂/SiO₂ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี ประสิทธิภาพในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสมากกว่า TiO₂ เพียงอย่างเดียว

ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	พื้นที่ผิ <mark>วจ</mark> ำเพาะ (m²/g)	ขนาดผลึก (nm)
TiO ₂	92	18
SiO ₂	289	NA
10% TiO ₂ /SiO ₂	282	9
20% TiO ₂ /SiO ₂	279	10
30% TiO ₂ /SiO ₂	279	10
40% TiO ₂ /SiO ₂	272	11
50% TiO ₂ /SiO ₂	264	12
1% Ag/30% TiO ₂ /SiO ₂	274	10

ตารางที่ 2.2 พื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/SiO₂

2.3.3 ผลกระทบของ SiO₂ ต่อความเป็นกรดบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂

การรายงานพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ที่มีความเป็นกรดสูง ช่วยในการ ปรับปรุงการสลายตัวของโมเลกุลของสารก่อมลพิษตามรายงานวิจัยของ Wei (2014) โดยที่ TiO₂ แสดงความเป็นกรดแบบลิวอิส (Lewis) ในขณะที่ TiO₂/SiO₂ แสดงความเป็นกรดแบบบรอนสเตด (Bronsted) ความเป็นกรดแบบบรอนสเตดมีความสำคัญสำหรับ TiO₂/SiO₂ โดยมี SiO₂ เป็น องค์ประกอบหลัก (Fateh, 2013) สังเกตว่าอัตราส่วนอะตอม Ti/Si สามารถใช้ควบคุมความเป็นกรด ของ TiO₂/SiO₂ โดยที่อัตราส่วนอะตอมของ Ti ต่อ Si เท่ากับ 4 แสดงความเป็นกรดแบบอิวอิสสูงสุด ในขณะที่ TiO₂/SiO₂ ที่มีอัตราส่วนอะตอม Ti ต่อ Si เท่ากับ 1 จะแสดงความเป็นกรดแบบอิวอิสสูงสุด ในขณะที่ TiO₂/SiO₂ ที่มีอัตราส่วนอะตอม Ti ต่อ Si เท่ากับ 1 จะแสดงความเป็นกรดแบบบรอนสเตด สูงสุด (Wei, 2014) โดยที่แสดงพันธะ Ti-O-Si ซึ่งเป็นพันธะกรดอย่างแรงในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของประจุ เนื่องจากเลขโคออร์ดิเนชันที่แตกต่างกันของ ศูนย์กลางโลหะ Ti และ Si ทำให้ประจุลบไม่สมดุลบน Ti-O และโปรตอน ถูกดึงจากโมเลกุลของ H₂O เกิดการสร้างหมู่ HO⁻ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นกรดของพื้นผิวและอัตราการสลายตัวของโมเลกุลของ สารเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากปริมาณที่มากขึ้นของหมู่ไฮดรอกซิลอยู่บนผิวของ TiO₂/SiO₂ บ่งบอก ประสิทธิภาพกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ TiO₂ (Kibombo, 2012) ความเป็น กรดเพิ่มการดูดซับบนพื้นผิวโดยที่หมู่ไฮดรอกซิลทำหน้าที่เป็นตัวดักจับอิเล็กตรอนและโฮลเกิดการ ออกซิไดซ์โมเลกุลของ H₂O ที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวช่วยเพิ่มการแยกประจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.4 ผลกระทบของ SiO2 ต่อแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/SiO2

ข้อเสียเปรียบของ TiO₂ คือการกลับมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วของอิเล็กตรอนและ โฮลที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแสงทำให้ประสิทธิภาพในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสลดลง การเติม SiO₂ ร่วมกับ TiO₂ ส่งผลให้แถบช่องว่างของพลังงานเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ค่าแถบช่องว่างพลังงาน และส่วนต่อประสานระหว่างเฟสออกไซด์ไม่ว่าจะเป็นเมทริกซ์ SiO₂ หรือผลกระทบของ SiO₂ บน พื้นผิวนำไปสู่การก่อตัวของพันธะ Ti-O-Si มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะตอม Ti อย่างมาก (Panayotov, 2003) ค่าแถบช่องว่างพลังงานของ TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ รายงานโดย Balachandran (2014) มีค่าเท่ากับ 3.3 และ 3.54 eV ตามลำดับ Bellardita (2010) มีการรายงานค่าแถบช่องว่าง ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ TiO₂-Cabot SiO₂ และ TiO₂/Axim SiO₂ มีค่าเท่ากับ 3.00 3.02 และ 2.98 eV ตามลำดับ แถบช่องว่างพลังงานที่กว้างขึ้นของ TiO₂/SiO₂ บ่งชี้ว่าอิเล็กตรอนและโฮลจะลดการ กลับมารวมตัวกัน (Kibombo, 2012) และความสามารถในการออกซิเดชันซึ่งกลไกเหล่านี้สามารถ ช่วยเพิ่มกิจกรรมโฟโตคะตะไลซิสของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ภายใต้แหล่งกำเนิดแสง

2.4 การประยุกต์ใช้กระบวนการโฟโตคะตะไ<mark>ล</mark>ซิสร่วมกับการกำจัดเชื้อจุลซีพและ มลพิษอินทรีย์

้ ปัจจุบันการกำจัด<mark>มล</mark>พิษอ<mark>ินทรีย์ได้รับความสนใจ</mark>อย่า<mark>งม</mark>ากควบคู่กับแนวโน้มในการพัฒนา เทคโนโลยีทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในกระบวนการนั้นคือกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (Fujishima, 2000; Sreeja, 2017; Ogorevc, 2012) งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอนุภาค นาโนของโลหะออกไซด์ <mark>เพื่อใช้เป็นวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรีย</mark>แบบใหม่โดยผสมผสานเทคนิค ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับคุณสมบัติต้า<mark>นแบคทีเรียของโลห</mark>ะอนินทรีย์ออกไซด์ (Raghunath, 2017; Shirzadi-Ahodashti; 2020) การพัฒนาวัสดุนาโนทางด้านโฟโตคะตะไลซิสโดยการถูกกระตุ้นให้มี คุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาในส่วนของไอออนจากกระบวนการ ์ โฟโตคะตะไลซิสที่สามารถละลายน้ำได้ในกรณีกำจัดมลพิษอินทรีย์ในน้ำ (Albers, 2013) งานวิจัยของ Sristina (2022) ได้ประยุกต์กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2-Ag และ SiO2-Ag ในการกำจัดเชื้อดื้อยาที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli พบว่าสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ้ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอโทรศัพท์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมและพิสูจน์ ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ ้อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สร้างสีที่เป็นอันตราย สารปนเปื้อน ้ถูกปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปลดปล่อยสารปนเปื้อนประมาณ 10–15% ของสีย้อมทั้งหมด โมเลกุลของสีย้อมประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ รวมทั้ง NH2 COOH และ SO3 ซึ่งอาจทำให้เกิด ้ปัญหาสุขภาพในมนุษย์ นอกจากนั้นโมเลกุลของสีย้อมส่วนใหญ่สามารถละลายน้ำได้สูง และไม่ สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Kshirsagar, 2018) การกำจัดทางชีวภาพ (Fernandez, 2018; Li, 2020) และการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีการโฟโตคะตะไลซิสเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง และไม่ต้องเพิ่มสารเคมีร่วมกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (Mamaghani, 2019; Zhang, 2020; Lai, 2021; Cannalire, 2021) จึงถูกนำมาประยุกต์อย่างแพร่หลายสำหรับการกำจัดสีที่ปนเปื้อน ในน้ำ การทดสอบการสลายเมทิลีนบลูร่วมกับ TiO2/SiO2 สลายเมทิลีนบลูได้สูงสุด 95.5% (รชานนท์, 2556) นอกจากนั้นรายงานการวิจัยของ รชานนท์ กลอนดอน (2556) ได้ประยุกต์กระบวนการโฟโต ้คะตะไลซิสในการกำจัดมลพิษทางอากาศโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ บนผิวเครื่องปั้นดินเผา ้ด่านเกวียน ซึ่งรายงานว่ามีประสิทธิภาพใน<mark>กา</mark>รสลายก๊าซ CO₂ อยู่ที่ 6.7-7.4% ในเวลา 5 ชั่วโมง ในส่วนงานวิจัยของ Junjian (2020) ได้ประย<mark>ุกต์</mark>กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ในการควบคุมการปลดปล่อยยาแล<mark>ะเทคโน</mark>โลยีชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็นพื้นฐานวัสดุนาโนทางชีว การแพทย์ จะเห็นได้ว่ากระบวนการโฟโต<mark>ค</mark>ะตะไ<mark>ล</mark>ซิสเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ได้รับความน่าสนใจ ้อย่างมากในการสลายมลพิษอินทรีย์ อีก<mark>ทั้</mark>งกระบ<mark>ว</mark>นการนี้ไม่ก่อผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ ้ประยุกต์เข้ากับงานได้หลากหลายสาข<mark>าไม่</mark>ว่าจะทาง<mark>ด้าน</mark>การแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร หรือการ ้ควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น<mark>เดีย</mark>วกับงานวิจัยนี้เป็นหนึ่งในการประยุกต์กระบวนการดังกล่าว ้เพื่อฆ่าเชื้อบนพื้นผิว ได้แก่ เชื้อ *E. coli* และการฆ่าเชื้อบ<mark>นพื้น</mark>ผิวอาหารโดยใช้ก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากา<mark>ศผ่าน</mark>กระบวนการโฟโตคะต<mark>ะไล</mark>ซิส ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ วัสดุคอมโพสิต

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

บทนี้แสดงวิธีการดำเนินงานวิจัยที่ครอบคลุมหัวข้องานวิจัย ภาพรวมของงานวิจัยดังแสดงใน รูปที่ 3.1 งานวิจัยเริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการจนถึงขั้นทำการประเมินความเป็นไปได้ ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มงานวิจัย โดยวิธีการดำเนินงานวิจัยในแต่ละ ส่วนจะอธิบายอย่างละเอียดในลำดับถัดไป



รูปที่ 3.1 ภาพรวมวิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 วิธีการทดลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย

ในหัวข้อนี้ทำการทดลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัยในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสร่วมกับการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ เพื่อสร้าง TiO₂/SiO₂ วัสดุคอมโพสิต เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้วิธีการจุ่มเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาลงบนวัสดุรองรับ (แผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S) ในงานวิจัยนี้ แกลบใช้เป็นแหล่งของ SiO₂ ซึ่งวิธีการดำเนินการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1.1 วัสดุและสารเคมี

- (1) ไทเทเนียม (เต<mark>ตร</mark>ะ) บิวทอกไซด์ (Titanium (IV) butoxide (C₁₆H₃₆O₄Ti), 97.0 (v/v)% Sigma-Aldrich, USA)
- (2) เอทานอลเข้มข้น (Ethanol absolute (C₂H₅OH), 99.9 (v/v)%
 Anapure, China)
- (3) กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid (H₂SO₄), 98.0 (v/v)% Anapure, China)
- (4) กรดในตริก (Nitric acid (HNO₃), 65 (v/v)% Carlo erba, Germany)
- (5) อ<mark>ะซิติ</mark>ลาซิโตน (Acetylacetone, Carlo erba, Germany)
- (6) น้ำปราศจากไอออน (Deionization water (H_2O))
- (7) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide (H₂O₂), 30 (v/v)% Carlo erba, Germany)
- (8) แกลบข้าว (Rice husk, Nakhon Ratchasima, Thailand)

3.1.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง

- (1) เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสต้นแบบที่ 1 (รูปที่ 3.2)
- (2) วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (รูปที่ 3.4)
 - (3) ชุดเครื่องกวนสาร (Magnetic stirrer + Magnetic bar; Xylem analysis, Germany)
 - (4) เครื่องกำเนิดความชื้นในอากาศ (Humidifier; Xiaomi Deerma F628S, China)
 - (5) เตาเผา (Furnace; Carbolite, United Kingdom)
 - (6) ตู้อบ (Oven; Binder, Germany)
 - (7) เครื่องจุ่มเคลือบและอุปกรณ์เครื่องแก้วต่าง ๆ
 - (8) ชุดอุปกรณ์วัดความเร็วลม (Hot Wire Anemometer; Digicon DA-44, Thailand and Anemometer Vane Probe; Digicon DA-42, Thailand)

(9) อุปกรณ์วัดความเข้มข้นก๊าซ H₂O₂ (H₂O₂ prob; Vaisala Indigo 201, Finland)

3.1.1.3 เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสและการติดตั้งอุปกรณ์การทดลองในห้อง ปฏิบัติการ

เครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิสจัดทำขึ้นในงานวิจัยสำหรับระบบก๊าซโดยมี องค์ประกอบสำคัญหลายส่วน ดังแสดงในรูปที่ 3.2 (ก) พัดลมดูดอากาศ (ข) อุปกรณ์วัดความเร็วลม (ค) แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) (ง) วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (จ) พัดลมระบาย อากาศ (ฉ) อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณภูมิของอากาศ และ (ช) อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ โดยที่ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นภายในเครื่องปฏิกรณ์ องค์ประกอบสำคัญในการเกิดปฏิกิริยามี 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (สารตั้งต้น) แหล่งกำเนิดแสง และตัวเร่งปฏิกิริยามี 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (สารตั้งต้น) แหล่งกำเนิดแสง และตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย แสง การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองสำหรับทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรก (A) ห้องควบคุม ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศโดยใช้เครื่องกำเนิดความชื้นเป็นตัวควบคุม ส่วนที่สอง (B) เครื่องปฏิกรณ์ โฟโตคะตะไลซิสสำหรับหน่วยปฏิกิริยา ส่วนสุดท้าย (C) ห้องทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ เพื่อวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้หลังถูกเจือจางด้วยปริมาตรของอากาศ เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสสำหรับระบบก๊าซถูกใช้ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ ก๊าซ H₂O₂ และศึกษาผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวน การโฟโตคะตะไลซิส

3.1.2 วิธีการท<mark>ดลอ</mark>ง

วิธีการทดลองในหัวข้อนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ โดยส่วนแรกกล่าวถึงการเตรียม ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยวิธีการโซล-เจล ส่วนที่สองคือการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้ บนแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ส่วนสุดท้ายเป็นการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่ทำการศึกษา โดยภาพรวมในส่วนแรกและส่วนที่สองดังแสดงในรูปที่ 3.3

3.1.2.1 การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์บริสุทธิ์

วิธีการเตรียมผงซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) จากแกลบเลือกใช้สภาวะการ เตรียมที่ดีที่สุดในรายงานวิจัยของ รชานนท์ กลอนดอน (2556) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ล้างแกลบให้สะอาดจากนั้นพักจนหมาด อบที่อุณหภูมิ 105°C เป็น
 เวลา 24 ชั่วโมง (ขั้นตอนล้างสิ่งสกปรกออกจากแกลบ)
- (2) นำแกลบที่ล้างแล้ว 100 กรัม ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริกความ เข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 1 ลิตร และกวนเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่ อุณหภูมิ 80°C พร้อมทำการรีฟลักซ์ (ขั้นตอนการกำจัดสารอินทรีย์บาง ชนิดออกจากแกลบ)
- (3) นำแกลบที่ต้มกับกรดไปล้างให้สะอาดจนค่า pH เท่ากับ 7 แล้วอบแห้ง
 ที่ 105℃ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

- (4) เผาแกลบในข้อที่ (3) ที่อุณหภูมิ 600℃ ในเตาเผาแบบใช้อากาศ อัตราการให้ความร้อน 5℃/นาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ขั้นตอนการเผา ไล่สารอินทรีย์และอนินทรีย์ในแกลบเพื่อให้ได้ SiO₂ บริสุทธิ์)
- (5) วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผง SiO₂ ที่สังเคราะห์ได้



รูปที่ 3.2 เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสต้นแบบที่ 1 (Tanongsak, 2022)



รูปที่ 3.3 ภาพรวมการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาลงบนแผ่น ตะแกรงสแตนเลสชนิด 3105

3.1.2.2 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงด้วยวิธีโซล-เจล

วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ เพื่อสร้าง วัสดุนาโนคอมโพสิต TiO₂/SiO₂ (Tanongsak, 2022) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

> เตรียมสารละลายโฟโตคะตะลิสต์ซึ่งประกอบไปด้วยไทเทเนียม(เตตระ) บิวทอกไซด์ปริมาตร 68 มิลลิลิตร เอทานอลเข้มข้นปริมาตร 210 มิลลิลิตร กรดไนตริกปริมาตร 2.56 มิลลิลิตร น้ำปราศจาก (DI water) ปริมาตร 5.5 มิลลิลิตร และอะซิติลาซิโตนปริมาตร 10.4 มิลลิลิตร
- (2) หลังจากเตรียมสารละลายในข้อที่ (1) เสร็จแล้ว เติมผงของ
 ซิลิกอนไดออกไซด์ ที่สังเคราะห์ได้ลงไปในอัตราส่วน TiO₂:SiO₂
 เท่ากับ 1:0.76 (w/w)%
- (3) กวนผสมสารละลายโฟโตคะตะลิสต์เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ80℃ ความเร็วรอบเท่ากับ 200 รอบต่อนาที พร้อมทำการรีฟลักซ์
- (4) ทิ้งสารละลายไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง สารละลายจะ กลายเป็นเจล
- (5) นำสารละลายเจลที่ได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 600℃ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการให้ความร้อน 5℃/นาที จะได้ผง TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ นำไป วิเคราะห์คุณส<mark>มบั</mark>ติทางกายภาพ
- (6) สารละลายเจลที่เตรียมได้ในข้อที่ (4) จะถูกนำไปเคลือบบนวัสดุรองรับ ตัวเร่งปฏิกิริยา (แผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S) ในลำดับถัดไป

3.1.2.3 การเคลือบตัวเร<mark>่ง</mark>ปฏิกิร<mark>ิย</mark>าด้วยแสงลงบนวัสดุรอ**งรับ**

การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ลงบนแผ่น ตะแกรงสแตนเลส 310S ด้วยวิธีจุ่มเคลือบ โดยเครื่องจุ่มเคลือบที่ใช้ในงานวิจัยนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน กลุ่มงานวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 3.5 สามารถควบคุมระยะของตำแหน่งและความเร็วในการจุ่มเคลือบได้ โดยขั้นตอนการจุ่มเคลือบมีรายล<mark>ะเอี</mark>ยดดังต่อไปนี้ (Tanongsak, 2022)

- (1) ทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ด้วยกรดซัลฟิวริก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่อัตราส่วนความเข้มข้น 1:1 โมลาร์ เป็น เวลา 30 นาที เพื่อกำจัดคาบสิ่งสกปรกหรือสารอินทรีย์บนพื้นผิว ลักษณะแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ดังแสดงในรูปที่ 3.4
- (2) อบแผ่นตะแกรงสแตนเลส 3105 ให้แห้งที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา
 24 ชั่วโมง
- (3) ทำการจุ่มเคลือบแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S กับสารละลายเจล 2 ชนิด ได้แก่ สารละลาย TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ โดยควบคุมความเร็ว ตำแหน่งและระยะเวลาในการจุ่มเคลือบ
 - (4) หลังจากจุ่มเคลือบสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้งที่
 อุณหภูมิห้องประมาณ 30 นาที
 - (5) นำแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ที่จุ่มเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาไปเผาที่ อุณภูมิ 600°C อัตราการให้ความร้อน 5°C/นาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะได้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เคลือบบนวัสดุรองรับ



รูปที่ 3.4 ลักษณะแผ่นตะแกรงสแตนเลสชนิด 3105



รูปที่ 3.5 เครื่องจุ่มเคลือบที่ใช้ในการทดลอง

3.1.2.4 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย

ในหัวข้อนี้จะแสดงตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลอง รวมถึงการออกแบบ การทดลองในการทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย ตัวแปรดังที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงตัวแปร บางตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเพื่อประเมินความเป็นไปได้ ดังแสดงในตาราง ที่ 3.1 เพื่อทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

การทดลอง	ตัวแปรต้น	ตัวแปรควบคุม	ตัวแปรตาม
ນອ	(1) ชนิดตัวเร่งปฏิกิริยา	(1) สัดส่วนระหว่าง	(1) ความหนาของชั้นฟิล์ม
ซล-เจ ริยา)S	ด้วยแสง	TiO ₂ :SiO ₂	(2) ความขรุขระบนพื้นผิว
วิธีโร ปฏิกิ 31(1.1)SiO ₂	(1:0.76 (w/w%))	(3) ลักษณะพื้นผิวรูพรุน
เด้วย วเร่ง มเลส	1.2)TiO ₂	(2) <mark>ก</mark> ารจุ่มเคลือบ	ของตัวเร่งปฏิกิริยา
ີ່ງເລືອງ ອີບສັ າແສາ	1.3)TiO ₂ /SiO ₂	2.1) ตำแหน่ง	(4) โครงสร้างผลึกของ
ารงล	H	2. <mark>2) ค</mark> วามเร็ว	ตัวเร่งปฏิกิริยา
ไวเร่ง คจุ่ม ตะแเ		2.3) <mark>เว</mark> ลา	(5) องค์ประกอบธาตุของ
าะท์ชั กคนิ แผ่น	A		ตัวเร่งปฏิกิริยา
เครา ใช้เา			(6) ความเข้มข้นของก๊าซ
ງຊື່ສູງ ແລະ ອຸ			H ₂ O ₂ ที่สังเคราะห์ได้
 بر			
۶	(1) คว <mark>ามชื้นในอากาศ</mark>	(1) ตัวเร่งปฏิกิริยา	(1) ความเข้มข้นของก๊าซ
ครา:	1.1)40% RH	TiO ₂ /SiO ₂	H ₂ O ₂ ที่สังเคราะห์ได้
รสังเ เอาก ซิส	1.2)50% RH		10
นกา กธ์ใน จะได	1.3)60% RH		
ข้องใ เป็มพัน ทุคะต	1.4)70% RH	เวรีเสี ⁵ ั	
กียว. เชิ่นสื่	(2) ความเร็วของอากาศ	าคเนเลยระ	
ปที่เมื่ มาวาม มการ	2.1) 5.1 m/s		
້າຍາກ ເບານ	2.2) 6.5 m/s		
ผลก O ₂ จ	2.3) 7.4 m/s		
สอบเ ช H ₂ ด้ว ถ	2.4) 8.2 m/s		
รทดเ			
LU LU			

ตารางที่ 3.1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัย

3.2 วิธีการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ และ การศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

จากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 4.1 ได้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความขึ้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ทดลอง อาทิเช่น ปัญหาการผสมกันระหว่างสารละลายโฟโตคะตะไลลิสต์ (ของเหลว) และ SiO₂ (ผงของแข็ง) ผสมกันได้ไม่ดี เกิดการแยกชั้นระหว่างของเหลวและของแข็งในขั้นตอนการรอ สารละลายให้กลายเป็นเจลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเคลือบสารละลายโฟ โตคะตะลิสต์ลงบนแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ที่ยึดเกาะได้ไม่ดี อันเนื่องมาจากขนาดอนุภาคของ SiO₂ ที่ผสมลงไปมีช่วงขนาดใหญ่เกินไป อีกทั้งยังทราบว่าชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการ สังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ คือตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/SiO₂ ดังนั้นวิธีการทดลองในหัวข้อนี้จะทำ การปรับปรุงการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/SiO₂ อาทิเช่น ศึกษาช่วงขนาดอนุภาค ของ SiO₂ ที่เหมาะสม ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส และส่วนสุดท้ายศึกษาบทบาทของ SiO₂ ทั้งทางกายภาพและทางเคมีในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส และส่วนสุดท้ายศึกษาปกปนี้

3.2.1 สารเคมีและอุป<mark>กรณ์</mark>ที่ใช้ในการทด<mark>ลอง</mark>

3.2.1.1 วัสดุแ<mark>ละส</mark>ารเคมี

- (1) ไทเทเนียม (เตตระ) นอร์มอล-บิวทอกไซด์ (Titanium (IV) n-
- butoxide (C₁₆H₃₆O₄Ti), 98 (v/v)% Acros organics, Belgium)
- (2) เอทานอลเข้มข้น (Ethanol absolute (C₂H₅OH), 99.9 (v/v)%
 Carlo erba, Germany)
 - (3) กรดในตริก (Nitric acid (HNO₃), 65 (v/v)% Carlo erba, Germany)
- (4) น้ำ DI (Deionization water (H₂O), 18.2 mΩ·cm)
 - (5) ซิลิกอนไดออกไซด์ที่สังเคราะห์จากแกลบตามหัวข้อ 3.1.2.1

3.2.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง

- (1) เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองดังที่กล่าวถึงในหัวข้อ 3.1.1.2
- (2) ถ้วยบดสาร
- (3) เครื่องเขย่าตะแกรง (Sieve shaker; Fritsch, Germany)
- (4) เครื่องอัลตร้าโซนิก (Ultrasonic cleaner; Angle technology Co., Ltd., Thailand)

3.2.2 วิธีการปรับปรุงการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและการออกแบบการ ทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ และบทบาทของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนแรกคือส่วนของการ ปรับปรุงการสังเคราะห์สารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงให้สามารถเคลือบได้ดีมากขึ้นและการ วิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ดังแสดงรายการในหัวข้อที่ 3.5 เพื่อศึกษาบทบาท ของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ สำหรับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ส่วนที่สองคือ การกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.2.1 วิธีการปรับปรุงกา<mark>รเต</mark>รียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยวิธีโซล-เจล

วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ (รชานนท์, 2556) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- เตรียมสารละลาย A โดยการเตรียมสารระหว่าง Titanium (IV) n-butoxide ปริมาตร 17 มิลลิลิตร ในสารละลายเอทานอลเข้มข้น ปริมาตร 40 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิห้อง
- (2) เตรียมสารละลาย B โดยผสมกรดในตริกเข้มข้นปริมาตร 3 มิลลิลิตร ลงในสารละลายเอทานอลเข้มข้นปริมาตร 35 มิลลิลิตร และน้ำ ปราศจากไอออนปริมาตร 15 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิห้อง
- (3) เติมผง SiO₂ ลงในสารละลาย A ในสัดส่วนต่าง ๆ (x %w/w) และ ขนาดอนุภาค ต่าง ๆ ในขณะปั่นกวนสารละลาย A
- (4) หยุดสารละลาย B ลงในสารละลาย A ทีละหยุด พร้อมกับกวนผสมให้ เข้ากันโดยใช้เครื่องกวนผสมสารที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที เป็น เวลาประมาณ 30-60 นาที สารละลายเริ่มกลายเป็นเจล (เมื่อ สารละลายเริ่มหนืดในระหว่างหยุดสาร B ใน A ในเพิ่มความเร็วในการ หยุดเพิ่มขึ้นเพื่อให้สารสามารถปั่นกวนต่อไปได้)
 - (5) หลังจากนั้นจะได้สารละลายที่พร้อมทำการจุ่มเคลือบบนวัสดุรองรับ ตัวเร่งปฏิกิริยาในลำดับถัดไป

3.2.2.2 การเคลือบสารละลายตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงลงบนวัสดุรองรับ

- (1) ลำดับแรกทำความสะอาดแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ด้วยเครื่อง อัลตร้าโซนิกที่อุณหภูมิ 40°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อกำจัดคราบสิ่ง ปนเปื้อนบนพื้นผิว หลังจากนั้นอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
- (2) ทำการจุ่มเคลือบตามหัวข้อ 3.1.2.3 ข้อย่อยที่ 3 ถึง 5

3.2.2.3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ และการศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิส

หัวข้อนี้จะแสดงตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม ในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความขึ้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อใช้เป็นสภาวะในการใช้ปรับปรุงเครื่อง ปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสในลำดับถัดไป และการศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในกระบวนการโฟโตคะตะ ไลซิสเพื่อใช้อธิบายกลไกเชิงลึกของ SiO₂ โดยการศึกษาผ่านการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ ขั้นสูง การออกแบบการทดลองในส่วนนี้ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

การทดลอง	ตัวแปรต้น		ตัวแปรควบคุม	ตัวแปรตาม		
	(1) ความชื้นสัมพัทธ์ใน	(1)	ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย	(1)	ความเข้มข้นของ	
	อากาศ		แสงชนิด TiO ₂		ก๊าซ H ₂ O ₂	
	1.1) 35-40% RH	(2)	<mark>ควา</mark> มเร็วของอากาศ		ที่สังเคราะห์ได้	
2	1.2) 40-45% RH		8.2 <mark>เมต</mark> รต่อวินาที			
H ₂ O	1.3) 45-50 <mark>% R</mark> H	(3)	แหล่ง <mark>กำเน</mark> ิดแสง			
ຳຮ	1.4) 50- <mark>5</mark> 5% RH		อัลตราไวโ <mark>อ</mark> เลต			
้มีเริ่	1.5) 55-60% RH	6	(UVC)			
ແຄະ ໃລສີເ	1.6) 60-65% RH	(4)	ระยะเวลาดำเนิน			
າລສູ ເອຍຸ	1.7) 65-70% RH	K	ปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง			
ในก <i>ั</i> โตค	1.8) 70-75% RH					
ะสม ารโพ	1.9) 75- <mark>80%</mark> RH		10	2		
เหมา	(2) ความเร็วของอากาศ	(1)	ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย	(1)	ความเข้มข้นของ	
วะที่ เระบ	2.1) 6.1 m/s		แสงชนิด TiO ₂		ก๊าซ H ₂ O ₂	
สภา	2.2) 8.2 m/s	(2)	ความชื้นสัมพัทธ์ใน		ที่สังเคราะห์ได้	
เหย	2.3) 11.0 m/s		อากาศที่เหมาะสม			
୭ଗ୍ର	2.4) 12.0 m/s	(3)	แหล่งกำเนิดแสง			
ทรา	2.5) 13.4 m/s		อัลตราไวโอเลต			
<i>د</i>			(UVC)			
		(4)	ระยะเวลาดำเนิน			
			ปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง			

ตารางที่ 3.2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษา<mark>หา</mark>สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ และ การศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในก<mark>ระ</mark>บวนการโฟโตคะตะไลซิส

การทดลอง	ตัวแปรต้น	ตัวแปรควบคุม			ตัวแปรตาม
	(3) ขนาดของ SiO ₂ ใน	(1)	อัตราส่วนระหว่าง	(1)	ความเข้มข้นของ
	ตัวเร่งปฏิกิริยา		TiO ₂ :SiO ₂ เท่ากับ		ก๊าซ H ₂ O ₂
	TiO ₂ /SiO ₂		1:0.01		ที่สังเคราะห์ได้
	3.1) <38 µm	(2)	ความชื้นสัมพัทธ์ใน		
	3.2) 38-45 μm		อากาศที่เหมาะสม		
	3.3) 45-53 μm	(3)	ความเร็วของ		
	3.4) 53-63 μm		อากาศที่เหมาะสม		
	3.5) 63-75 μm	(4)	แหล่งกำเนิดแสง		
			อัลตราไวโอเลต		
1 ₂ O ₂		(5)	ระยะเวลาดำเนิน		
<u>କ</u> ାର୍ଥ			ปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง		<u>ع</u> ر ال
ะห์กั	(4) สัดส่วน TiO ₂ /Si <mark>O₂</mark>	(1)	ค <mark>วาม</mark> ชื่นสัมพัทธ์ใน	(1)	ผลกระทบต่อพื้นที่ผิว -
คราะ ลซิส	4.1) TiO ₂ /1%SiO ₂		อากา <mark>ศที</mark> ่เหมาะสม		จำเพาะ
รสังเ เตะไว	4.2) TiO ₂ / <mark>3%</mark> SiO ₂	(2)	ความเร็วของ	(2)	ผลกระทบต่อขนาด
นกา	4.3) TiO ₂ /5%SiO ₂		อากาศที่เห <mark>มา</mark> ะสม		และโครงสร้างผลิก
ัสมใ รโฟโ	4.4) TiO ₂ /7%SiO ₂	(3)	แหล่งก้าเนิดแสง	(3)	ผลกระทบต่อความ * ~
າມາະ	4.5) TiO ₂ /10%SiO ₂		อัลตราไวโอเลต		หนาของชั้นเคลือบ
ะที่เร	4.6) TiO ₂ /20%SiO ₂	(4)	ระยะเวลาดำเนิน		และความขรุขระบน
<i></i> ມາງ: ມຍກຽ			ปฏิกรัยา 2 ชั่วไม่ง	100	พ้นผัว
หาส ด้ว		(5)	ขนาดของผง SiO ₂	(4)	ผลกระทบต่อแถบ
ត្តិ១។	John		ในตวเรงปฏกรียาท่		ชองวางพลงงานของ
รทค	"ยาลยเ	าค	เหมาะสม		ตวเรงปฏ่กรียา
มา				(5)	ผลกระทบตอตวเรง
					ปฏกรยาโนการ
					ปลดปลอยอเลกตรอน ร
					และเฮล
				(6)	ผลกระทบตอหมู ฯ
					พงกชนบนพนผว
				(7)	ความเขมขนของกาซ แ
					H₂O₂ พลงเคราะหเด

ตารางที่ 3.2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ และ การศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (ต่อ)

3.3 วิธีการทดลองเพื่อทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้

การทดลองในส่วนนี้เป็นการศึกษาการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะ การทำงานที่ดีที่สุดของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ เมื่อถูกเจือจางด้วยปริมาตรของอากาศในห้องจำลองหรือห้องที่ใช้ในการทดสอบการ ี้ฆ่าเชื้อ E. coli และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอาหารในลำดับถัดไป จากผลการทดสอบการกระจายตัวของ ก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ในห้องทดสอบการกระจายตัวปริมาตร 2 m³ (รูปที่ 3.2(C)) พบว่าเครื่องวัด ้ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ไม่สามารถตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ ้ว่าระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ถูกเจือจางด้วยปริมาตรของอากาศที่มากเกินไป เมื่อเทียบกับระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ อาจจะอยู่ ในค่าที่ต่ำกว่าความสามารถของเครื่องวัดคว<mark>าม</mark>เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ตรวจวัดได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงลด ขนาดของห้องทดสอบการกระจายตัวของ<mark>ก๊าซ H</mark>₂O₂ จากปริมาตร 2 m³ เป็น 0.027 m³ (30 cm x 30 cm x 30 cm) (รูปที่ 3.6(C)) และได้ปรับปรุงเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสก่อนหน้า (รูปที่ 3.2(B)) โดยเพิ่มหน่วยในการเกิดปฏิกิริยา<mark>เ</mark>รียงต่อ<mark>กันแบบอนุกรมเพื่อศึกษาแนวโน้มของระดับความ</mark> เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ไ**ด้โด**ยต่อแบบ<mark>อนุ</mark>กรม 2 และ 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา (รูปที่ 3.7(B)) เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสสำหรับระบบก<mark>้า</mark>ซจัดทำขึ้นในงานวิจัยมีองค์ประกอบสำคัญ หลายส่วน (ก) พัดลมดูดอากาศ (ข) อุปกรณ์วัดความเร็วลม (ค) แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) (ง) วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (จ) พัดลมระบายอากาศ (ฉ) อุปกรณ์วัดความชื้นและ อุณภูมิของอากาศ และ (ช) อุปกร<mark>ณ์วัดความเข้มข้นของก</mark>าซ H₂O2 การปรับปรุงเครื่องปฏิกรณ์โฟโต คะตะไลซิสมีการเพิ่มหน่<mark>วยก</mark>รอ<mark>งอากาศและกรองความชื้น ดังแส</mark>ดงในรูปที่ 3.6-7(ซ) เพื่อป้องกัน การย้อนกลับของก๊าซ H₂O₂ ที่ทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์และป้องกันการปนเป็นของอากาศก่อนเข้าห้อง จำลองการกระจายตัวของก<mark>้าซ H₂O</mark>2



รูปที่ 3.6 แผ่นกรองความชื้นและอากาศ



รูปที่ 3.7 เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสต้นแบบที่ 2 แบบอนุกรม 2 และ 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา

3.3.1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองเพื่อทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ และผลกระทบของการเพิ่มหน่วยการเกิดปฏิกิริยาของเครื่อง ปฏิกรณ์

หัวข้อนี้จะแสดงตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองเพื่อทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้และศึกษาผลกระทบของการเพิ่มหน่วยการเกิดปฏิกิริยาของเครื่องปฏิกรณ์โดย การต่อแบบอนุกรม 2 และ 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา ทดสอบที่สภาวะการทำงานที่ดีที่สุดของเครื่อง ปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสที่ได้ทำการศึกษาในหัวข้อ 3.2 สำหรับการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ซึ่งการออกแบบการทดลองในส่วนนี้ ดังแสดงใน ตารางที่ 3.3

การทดลอง	ตัวแปรต้น	ตัวแปรควบคุม			ตัวแปรตาม
	(1) รูปแบบเครื่องปฏิก <mark>รณ์</mark>	(1)	<mark>สภา</mark> วะการสังเคราะห์	(1)	ความเข้มข้น
	(ต่อแบบอนุกรม)		์ ก <mark>๊าซ</mark> H ₂ O ₂ จาก		ของก้ำซ H ₂ O ₂
	1.1) 1 ชุด		ความ <mark>ชื้นส</mark> ัมพัทธ์ใน		ที่สังเคราะห์ได้ที่ถูก
	1.2) 2 ชุด		อากาศ <mark>ที่เห</mark> มาะสมจาก		เจือจางด้วย
ا ھ	1.3) 3 ชุด		การทดลอง <mark>หั</mark> วข้อ 3.2		ปริมาตรอากาศ
าะห้	1.4) <mark>3 ชุ</mark> ด (แผ่นกรอง)	(2)	ตำแหน่งวัดก <mark>๊าซ</mark> H ₂ O ₂		ภายในห้องจำลอง
້າ ເຈົ້າ			(ภายในเครื่อง		ขนาด 0.027 m ³
2 Mg.			ปฏิกรณ์)		
H2O ೫೯೪೫	(1) ตำแหน่ <mark>งวัดการ</mark>	(1)	<mark>สภาวะการสังเ</mark> คราะห์	(1)	ความเข้มข้นของ
ก๊าซ โฟโเ	กระจายตัวของก๊าซ		ก้าซ H ₂ O ₂ จาก		ก้ำซ H ₂ O ₂
າຫອງ ງິກຽຄ	H ₂ O ₂		ความชื้นสัมพัทธ์ใน		ที่สังเคราะห์ได้
ายตั องปฏิ	2.1) เครื่องปฏิกรณ์	าค	อากาศที่เหมาะสมจาก		(ภายในเครื่อง
າຮູ ແຄຊູ່	2.2) ห้องจำลอง		การทดลองหัวข้อ 3.2		ปฏิกรณ์และ
การเ		(2)	รูปแบบเครื่องปฏิกรณ์		ภายในห้องจำลอง)
สอบ			ต่อแบบอนุกรม 3		
พด			หน่วยเกิดปฏิกิริยา		
			(แบบเพิ่มและไม่เพิ่ม		
			แผ่นกรองอากาศ)		
		(3)	ปริมาตรห้องจำลอง		
			เท่ากับ 0.027 m ³		

ตารางที่ 3.3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษ<mark>าการกร</mark>ะจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ในห้องจำลอง

3.4 วิธีการทดสอบการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวด้วยก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จากเครื่อง ปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส

การทดลองในส่วนนี้จะกล่าวถึงการสังเคราะห์อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Luria-Bertani (LB) liquid medium และการทดสอบการยับยั้งเชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะการทำงาน ที่ดีที่สุดของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส โดยชนิดเชื้อที่ใช้ทดสอบในงานวิจัยนี้ได้แก่ *Escherichia coli (E. coli)* และการทดสอบการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอาหาร ซึ่งรายละเอียดของการทดลองในส่วน นี้มีดังต่อไปนี้

3.4.1 สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.4.1.1 วัสดุและสารเคมี

- (1) ทริปโตน (Tryptone, HIMEDIA, India)
- (2) โซเดียมคลอ<mark>ไรด์ (So</mark>dium chloride (NaCl), Carlo erba, Germany)
- (3) สารสกัดจา<mark>ก</mark>ยีสต์ (Yeast extract, Himedia, India)
- (4) น้ำปราศจากไอออน (Deionization water (H₂O), 18.2 mΩ·cm)

3.4.1.2 เครื่องมือแ<mark>ละอ</mark>ุปกรณ์กา<mark>รทด</mark>ลอง

- ชุดเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสตามที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ 3.3
- (2) จ<mark>านอ</mark>าหารเลี้ยงเชื้อ
- (3) อุปกรณ์เครื่องแก้วต่าง ๆ
- (4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
- (5) ไมโครปีเปตต์และไมโครปีเปตต์ทิป

3.4.2 การสังเคราะห์อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Luria-Bertani (LB) liquid medium

วิธีการสังเคราะห์อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ E. coli มีขั้นตอน การเตรียมดังต่อไปนี้

- (1) เตรียมสารละลายผสมประกอบด้วยน้ำปราศจากไอออนปริมาตร 950 มิลลิลิตร ทริปโตนจำนวน 10 กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน 10 กรัม และสารสกัดจาก ยีตส์จำนวน 5 กรัม เขย่าผสมสารทั้งหมดให้เข้ากัน
- (2) ปรับ pH เท่ากับ 7 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5N (ประมาณ 0.2 มิลลิลิตร)
- (3) ปรับปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำปราศจากไอออน
- (4) ฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อเป็นเวลา 20 นาที
- (5) วัดค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
 600 นาโนเมตร ปรับค่า OD เท่ากับ 0 ในส่วนของอาหารที่เติมเชื้อ E. coli ปรับ

ค่า OD ให้เท่ากับ 0.05 หลังจากนั้นปีเปตต์สารละลายลงบนจานเลี้ยงเชื้อ 1 ถึง 3 มิลลิลิตร

3.4.3 การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของ อาหารด้วยก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้

การทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอาหารเป็นการทดสอบ เบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โฟ โตคะตะไลซิสที่ดีที่สุด เพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli และเชื้อบนพื้นผิวของ อาหาร การออกแบบการทดลองดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้

3.4.3.1 การทดสอบการฆ่<mark>าเ</mark>ชื้อ *E. coli* ด้วยเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสแบบ ปราศจากแผ่นกรอ<mark>งอ</mark>ากาศ

การออกแบบการทดลองในส่วนนี้ เป็นการทดสอบการฆ่าเชื้อโดยปราศจาก แผ่นกรองอากาศในตัวเครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิสก่อนปล่อยสารผลิตภัณฑ์ (ก๊าซ H₂O₂ และสาร ตั้งต้น) เข้าสู่ห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* ศึกษาผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ยัง หลงเหลือจากการเกิดปฏิกิริยา โดยการทดสอบดำเนินการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากสภาวะการ ทำงานที่ดีที่สุดของเครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิส ดังแสดงในรูปที่ 3.8 (A) ห้องควบคุมความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศ (B) เครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิส ดังแสดงในรูปที่ 3.8 (A) ห้องควบคุมความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศ (B) เครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิสแบบอนุกรม 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา และ (C) ห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* ตำแหน่งของจานอาหารเลี้ยงเชื้อถูกวางที่ระนาบเดียวกัน (ระนาบ ต่ำสุด) โดยเชื้อ *E. coli* ที่ถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเริ่มต้นมีค่า OD เท่ากับ 0.05 หลังจากนั้นทดสอบ การฆ่าเชื้อในห้องจำลองเป็นระยะเวลา 1 ถึง 6 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าความขุ่นชั่วโมงละ 3 ตัวอย่าง (N=3) ปริมาตรรวมของเชื้อและอาหารต่อหนึ่งจานอาหารเลี้ยงเชื้อเท่ากับ 2.5 มิลลิลิตร ทำการทดสอบพร้อมกันสองชุดการทดลอง โดยชุดแรกทดสอบในห้องฆ่าเชื้อที่มีก๊าซ H₂O₂ กระจาย ตัวอยู่ (ห้องจำลองปริมาตร 0.027 m³) ชุดที่สองทำการทดสอบในภายนอกห้องฆ่าเชื้อโดยปราศจาก ก๊าซ H₂O₂ ดังแสดงในรูปที่ 3.9 หลังจากครบตามเวลากำหนดนำเชื้อจากจานอาหารเลี้ยงเชื้อไปวัดค่า ความขุ่นด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง

3.4.3.2 การทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอาหารด้วย เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสแบบมีแผ่นกรองอากาศ

การออกแบบการทดลองในส่วนนี้ เป็นการทดสอบการฆ่าเชื้อโดยมีหน่วย กรองอากาศร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส ก่อนปล่อยสารผลิตภัณฑ์ (ก๊าซ H₂O₂ และสารตั้ง ต้น) เข้าสู่ห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ ศึกษาผลกระทบของการกรองความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ยัง หลงเหลือจากการทำปฏิกิริยาไม่ให้ผ่านเข้าไปในห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ โดยการทดสอบดำเนินการ สังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากสภาวะการทำงานที่ดีที่สุดของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส ดังแสดงใน รูปที่ 3.10 (A) ห้องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (B) เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสแบบอนุกรม 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา และ (C) ห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ สำหรับการทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* มี การวางตำแหน่งจานอาหารเลี้ยงเชื้อระนาบแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับบน (N1) ระดับกลาง (N2) และ ระดับล่าง (N3) การทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยเชื้อ *E. coli* ที่ถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเริ่มต้น ที่ค่า OD เท่ากับ 0.05 หลังจากนั้นทดสอบการฆ่าเชื้อในห้องจำลองเป็นระยะเวลา 1 ถึง 6 ชั่วโมง เก็บ ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าความขุ่น ชั่วโมงละ 3 ตัวอย่าง (N=3) ปริมาตรเชื้อและอาหารรวมในจาน เลี้ยงเชื้อเท่ากับ 1 มิลลิลิตร ทำการทดสอบพร้อมกันสามชุดการทดลอง โดยชุดแรกทดสอบในห้อง ฆ่าเชื้อที่มีก๊าซ H₂O₂ กระจายตัวอยู่ (ห้องจำลองปริมาตร 0.027 m³) ชุดที่สองทำการทดสอบใน ภายนอกห้องฆ่าเชื้อโดยปราศจากก๊าซ H₂O₂ ชุดที่สามทดสอบภายนอกห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในรูป ที่ 3.10 หลังจากครบตามเวลากำหนดนำเชื้อจากจานอาหารเลี้ยงเชื้อไปวัดค่าความขุ่นด้วยเครื่องวัด การดูดกลืนแสง

ในส่วนของการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอาหาร ทำการทดสอบร่วมกับอาหารหลายชนิด ที่ถูกวางจำหน่ายโดยทั่วไปในชั้นวางห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ขนมปัง แอปเปิ้ล ถั่วลันเตา หัวหอมแดง เป็นต้น ทำการทดสอบการฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จากสภาวะที่ดีที่สุดของเครื่อง ปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส เป็นระยะเวลา 30 นาที 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงครึ่ง และ 2 ชั่วโมง แต่ละ ช่วงเวลาดังกล่าวเก็บตัวอย่างครั้งละ 2 ตัวอย่าง (N=2) ระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อขึ้นอยู่กับการ เปลี่ยนแปลงของเชื้อบนพื้นผิวอาหาร



รูปที่ 3.8 รูปแบบการทดสอบการฆ่าเชื้อแบบที่ 1

		1	1 ชั่วโมง					2 ชั่วโมง					
	1	A	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
E A		. 18	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
T			11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	
	21 16 11 6 22 17 12		16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	
	²³ 18 13 4 19 14		21	22	23	24		21	22	23	24		
	20 15 1	0 5	3	ชั่วโมง				4	4 ชั่วโมง				
		XX	ŧ	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
and the second second		ă I	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
	5		11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	
195	0 1 2 4 5	3	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	
	7 8	9	21	22	23	24		21	22	23	24		
7	10 11	12	- 5	ชั่วโมง				6	ชั่วโมง	I			
(mil	13 14	15	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
- Carlos (16 17	18	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
22	20	21	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	
A.	23	24	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	
1 (16)	2 (16)	2(16)	21	22	23	24		21	22	23	24		
1 (III)	2 (IN)	5 (III)	7	ชั่วโมง				8	ชั่วโมง	1			
4 (5h)	s (51)	0 (5h)	(อ	หารทดส	สอบไม่	เพียงพ	อ)	(อ	าหารทด	สอบไม	เพียงท	lə)	
10	0	9 (5h)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
10	14	15 (45)	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
16 (26)	17 (46)	19 (2h)	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	
10 (3h)	17 (4n)	18 (2n)	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	
19 (4h)	20 (6h)	21 (2h)	21	22	23	24		21	22	23	24		
22 (6h)	23 (6h)	24 (2h)											

รูปที่ 3.9 ตำแหน่งการหยิบสุ่มตัวอย่างชั่วโมงละ 3 ตัวอย่าง กรณีปราศจากแผ่นกรองอากาศ



รูปที่ 3.10 ตำแหน่งการหยิบสุ่มตัวอย่างชั่วโมงละ 3 ตัวอย่าง กรณีมีแผ่นกรองอากาศ

3.5 เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงในงานวิจัย

เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ถูกใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและ ทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อประกอบการอธิบายกลไกเชิงลึกของกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการฆ่าเชื้อ *E. coli* ด้วยก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

- เครื่องวิเคราะห์เฟสและโครงสร้างผลึก (X-ray diffraction; XRD)
 ยี่ห้อ Bruker รุ่น D2 phaser
 หมายเหตุ: วิเคราะห์โครงสร้างเฟสและผลึกของตัวเร่งปฏิกริยาด้วยแสง ได้แก่ โครงสร้าง
 อนาเทสและรูไทล์สำหรับ TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ และโครงสร้างอสัณฐานสำหรับ SiO₂
- (2) เครื่องวิเคราะห้องค์ประกอบธาตุ (Energy dispersive X-ray fluorescence; EDXRF) ยี่ห้อ Horiba รุ่น XGT-5200
 หมายเหตุ: วิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของ SiO₂ ที่สังเคราะห์ได้
- (3) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Ultraviolet-visible spectroscopy; UV-vis) ยี่ห้อ Agilent รุ่น Cary 300 หมายเหตุ: วิเคราะห์แถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (energy band gap) ได้แก่ TiO₂ TiO₂/SiO₂ และ SiO₂
- (4) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะ (Surface area pore size and pore volume distribution analyzer; BET)

ยี่ห้อ Bel-Jap<mark>an</mark> รุ่น <mark>Belso</mark>rp mini II

หมายเหตุ: วิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะ ปริมาตรรูพรุน และขนาดรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสง

 (5) เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectroscopy; FTIR)
 ยี่ห้อ Bruker รุ่น Tensor 27

หมายเหตุ: วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

- (6) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Ultraviolet-visible spectroscopy; UV-vis)
 ยี่ห้อ HACH รุ่น DR 6000
 หมายเหตุ: วิเคราะห์ค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อดูการเจริญเติบโตของเชื้อ
 E. coli หลังทำการยับยั้งด้วยก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้
- (7) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) ยี่ห้อ TESCAN รุ่น.MIRA 3 หมายเหตุ: วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชั้นเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงบนวัสดุรองรับ ตัวเร่งปฏิกิริยา (แผ่นสแตนเลส 310S)

(8) เครื่องวิเคราะห์ความขรุขระและความหนาของพื้นผิว (Contour GT 2D and 3D) ยี่ห้อ Bruker รุ่น ContourGT-I

หมายเหตุ: วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชั้นเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงบนวัสดุรองรับ ตัวเร่งปฏิกิริยา (แผ่นสแตนเลส 310S)

(9) เครื่องอิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์หรืออิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (Electron paramagnetic resonance; EPR or Electron spin resonance; ESR) ยี่ห้อ Bruker รุ่น EMXmicro

หมายเหตุ: วิเคราะห์การปลดปล่อยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

(10) Field emission scanning electron microscope (FE-SEM) with wavelength dispersive x-ray spectroscopy (WDX) and energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX)

ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM 7800F

หมายเหตุ: วิเคราะห์ลักษณ<mark>ะ</mark>พื้นผิวแล<mark>ะ</mark>ตำแหน่งธาตุของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

3.6 การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ เบื้องต้น

ได้จากการการประเมินแผนธุรกิจเบื้องต้นในงา<mark>นวิจั</mark>ยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใน งานวิจัยสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถเกิดขึ้นประยุกต์ความรู้ในงานวิจัย โดยจะนำเสนอแบบ จำลองธุรกิจ (business model canvas; BMC) ของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.6.1 แบบจ<mark>ำลอง</mark>ธุรกิจ

แบบจ<mark>ำลองธุ</mark>รกิจเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการอ<mark>อกแบ</mark>บรูปแบบธุรกิจผ่านองค์ประกอบ 9 อย่างที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย

- (1) ลูกค้า คือ ผู้ซื้อสิ<mark>นค้าหรือบริการ</mark>
- (2) คุณค่า คือ จุดขายของสินค้าหรือบริการ
- (3) ช่องทาง คือ สื่อ แพลตฟอร์ม รูปแบบ และวิธีในการสื่อสารไปถึงลูกค้า
- (4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า คือ วิธีในการรักษาฐานลูกค้า
- (5) กระแสรายได้ คือ รายได้ของธุรกิจ
- (6) ทรัพยากรหลัก คือ สิ่งที่ต้องมีในการดำเนินธุรกิจ
- (7) กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ต้องทำเพื่อให้รูปแบบธุรกิจอยู่ต่อได้
- (8) พันธมิตรหลัก คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการช่วยป้อนวัตถุดิบและการช่วยขาย
- (9) โครงสร้างต้นทุน คือ ต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจ

บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล

บทนี้นำเสนอผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผลในหัวข้อที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ งานวิจัย ประกอบด้วยผลการศึกษา 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกผลการทดสอบความเป็นไปได้ของ งานวิจัย ส่วนที่สองผลการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพันธ์ใน อากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ส่วนที่สามบทบาทของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ สำหรับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ส่วนที่สี่ผลการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ในห้อง จำลองร่วมกับทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอาหาร ส่วนสุดท้ายผลการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ ซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปนี้

4.1 ผลการทดสอบความเป็น<mark>ไปไ</mark>ด้ของงา<mark>นวิจั</mark>ย

หัวข้อนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัยในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความซื้น สัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการศึกษาเชิงลึกใน ลำดับถัดไปของงานวิจัย ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ในการเร่งปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาถูกเตรียมด้วยวิธีโซล-เจล และใช้เทคนิคจุ่มเคลือบในการเคลือบตัวเร่ง ปฏิกิริยาลงบนวัสดุรองรับ (แผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S) อีกทั้งยังศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ได้แก่ ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา ความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศ ความเร็วของอากาศ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะแสดงอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้

4.1.1 คุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด TiO₂ SiO₂ และ TiO₂/SiO₂ 4.1.1.1 การวิเคราะห์การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีโซล-เจล

การสังเคราะห์ SiO2 จากแกลบถูกเตรียมโดยสภาวะที่ดีที่สุดตามรายงาน

การวิจัยของ รชานนท์ กลอนดอน (2556) วิธีการดำเนินการถูกกล่าวอย่างละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.2.1 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนของกลไกการสังเคราะห์ SiO₂ ความบริสุทธิ์สูงและการปรากฏ โครงสร้างรูพรุนบนอนุภาคของ SiO₂ ดังแสดงในรูปที่ 4.1 ในขั้นแรกล้างทำความสะอาดแกลบเพื่อ กำจัดสิ่งเจือปนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ออกไปบนพื้นผิวแกลบ เช่น ฝุ่น เศษพืช และดิน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบของแกลบประกอบด้วยประกอบสารอินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ ลิกนิน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ประมาณ 75 ถึง 80 ร้อยละโดยน้ำหนัก (wt.%) และซิลิกาประมาณ 15 ถึง 20 wt.% (Zhuqing, 2022) หลังจากนั้นขั้นตอนการต้มแกลบด้วยกรด H₂SO₄ ด้วยความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ จะช่วยกำจัดองค์ประกอบบางส่วนที่มีอยู่ในแกลบ อาทิเช่น สี สารประกอบอินทรีย์และ อนินทรีย์หรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ หลังจากนั้นเผาที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ขั้นตอนนี้จะทำให้ โมเลกุลของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่อยู่บนอนุภาค SiO₂ กลายเป็นไอสารเคมีระเหยออกจากพื้นผิว ก่อให้เกิดหลุมของโมเลกุลเหล่านั้นปรากฏบนพื้นผิว SiO₂ หรือที่เรียกว่า รูพรุน (Tang, 1964) ดังแสดงในรูปที่ 4.2(a) TiO₂ แสดงลักษณะผลึกค่อนข้างเรียบเมื่อเทียบกับพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ ผสมด้วย SiO₂ (รูปที่ 4.2(b)) และตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ แสดงการก่อโครงสร้างพื้นผิวใหม่ ระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ (รูปที่ 4.2(c)) การสังเคราะห์ SiO₂ ที่สภาวะดังกล่าวได้ร้อยละผลได้ ของ SiO₂ จากแกลบร้อยละ 24.39 วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุด้วยเทคนิค XRF ดังแสดงในรูปที่ 4.1 พบความบริสุทธิ์ของ SiO₂ ร้อยละ 99.402 ซึ่งยังพบว่ามีองค์ประกอบของธาตุอื่นผสมอยู่ ได้แก่ SO₃ CaO Fe₂O₃ และ ZnO โดยมีร้อยละเท่ากับ 0.248 0.325 0.013 และ 0.011 ตามลำดับ เมื่อทำการ วิเคราะห์พื้นผิวด้วยวิธี BET พบว่า SiO₂ ที่สังเคราะห์ได้มีพื้นที่ผิวจำเพาะเท่ากับ 158.49 m²/g ปริมาตรรูพรุนเท่ากับ 0.3091 cm³/g และขนาดการกระจายรูพรุนเท่ากับ 7.800 นาโนเมตร ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพทางพื้นผิวของ SiO₂ คาดว่าจะเป็นหนึ่งในกลไกที่สามารถช่วยเร่งปฏิกิริยา ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

จากรูป 4.3 ได้ทำการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในสภาวะที่ดีที่สุดในรายงาน วิจัยของ รชานนท์ กลอนดอน (2556) หลังจากเผาตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ SiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการให้ความร้อน 5°C/นาที ในเตาเผาแบบใช้อากาศ รูปแบบของ XRD (X-ray diffraction) สำหรับ SiO₂ ปรากฏโครงสร้างอสัณฐานและปริมาณเฟสผลึก TiO₂ แสดงโครงสร้างผลึกแบบอนาเทส ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับงานวิจัยที่อ้างอิงการ สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว โดยการสังเกตจากตำแหน่งพีคที่ 20 สำหรับโครงสร้างอนาเทสของ TiO₂ อ้างอิงตามมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 84-1286 พบตำแหน่งพีคที่ 25.4° 37.0° 38.0° 38.8° 48.0° 54.0° 55.2° 62.9° 68.9° และ 70.5° ซึ่งสอดคล้องกับระนาบผลึก 101 103 004 112 200 105 211 118 116 และ 220 (รูปที่ 4.3(a)) สำหรับการเลี้ยวเบนของ XRD ในการวิเคราะห์โครงสร้าง ของ SiO₂ พบพีครูปแบบโครงสร้างอสัณฐาน (รูปที่ 4.3(c)) และตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ปรากฏ โครงสร้างที่ทับซ้อนกันระหว่าง SiO₂ โครงสร้างอสัญฐานและ TiO₂ โดรงสร้างผลึกรูปแบบอนาเทส ซึ่งช่วยยืนยันว่าตัวเร่งปฏิกิริยาสองชนิดนี้ผสมเข้ากันเป็น TiO₂/SiO₂ วัสดุคอมโพสิตได้เป็นอย่างดี (รูปที่ 4.3(b))

รูปที่ 4.4 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคจากเครื่องมือวิเคราะห์ FESEM/ EDX โดยเทคนิค EDX (Energy dispersive x-ray spectroscope) ของผงตัวเร่งปฏิกิริยา SiO₂ TiO₂ และTiO₂/SiO₂ ตามลำดับ แสดงองค์ประกอบธาตุของตัวเร่งปฏิกิริยาดังต่อไปนี้ ตัวเร่งปฏิกิริยา SiO₂ พบองค์ประกอบของธาตุออกซิเจน (O) และซิลิกอน (Si) เท่ากับ 42.69 และ 57.31 ร้อยละโดย น้ำหนัก (wt.%) เมื่อเทียบโดยสัดส่วนอะตอม (ac.%) มีค่าเท่ากับ 29.81 และ 70.19 ตามลำดับ (รูปที่ 4.4(a)) ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ พบองค์ประกอบของธาตุไทเทเนียม (Ti) และออกซิเจน (O) เท่ากับ 75.77 และ 24.23 wt.% เมื่อเทียบสัดส่วนอะตอมมีค่าเท่ากับ 51.10 และ 48.90 ac.% ตามลำดับ (รูปที่ 4.4(b)) ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ พบองค์ประกอบของธาตุไทเทเนียม (Ti) ซิลิกอน (Si) และออกซิเจน (O) เท่ากับ 41.63 19.98 และ 38.39 wt.% เมื่อเทียบสัดส่วนอะตอมมีค่าเท่ากับ 21.87 17.87 และ 60.26 ac.% ตามลำดับ (รูปที่ 4.4(c)) ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งของธาตุ Ti Si และ O อยู่บนตำแหน่งเดียวกันแสดงว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้มีการ กระจายตัวของอนุภาค TiO₂ ได้ดีบนพื้นผิวอนุภาค SiO₂ ที่มีโครงสร้างรูพรุนบนพื้นผิว



รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการทำบริสุทธิ์ SiO2 และการเกิดโครงสร้างรูพรุนบนพื้นผิว SiO2



รูปที่ 4.2 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาค FESEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ละชนิด (Tanongsak, 2022)

4.1.1.2 การวิเคราะห์พื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกเคลือบบนแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ด้วยวิธีการจุ่มเคลือบ

วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ แผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S เนื่องจากขั้นตอนการเผาเพื่อให้ได้เฟสผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพในการเร่ง ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสถูกดำเนินการเผาแบบใช้อากาศที่อุณหภูมิสูง (600°C) นอกจากนั้นการเจาะ รูหรือการขึ้นรูปแผ่นวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาทำได้ง่ายและคงทนกว่าวัสดุชนิดอื่น มีคุณสมบัติ ป้องการเกิดออกซิเดชันบนพื้นผิวในการเกิดสนิมของน้ำได้ดี อีกทั้งยังทนต่อแสงอัลตราไวโอเลตถูกใช้ ในการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในกระบวนการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ โดยองค์ประกอบทางเคมีของแผ่น ตะแกรงสแตนเลส 310S จากบริษัทผู้ผลิต (Amirkhiz, 2019) ที่ยังไม่ได้ทำการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ใช้ในการศึกษานี้มีองค์ประกอบ (ร้อยละโดยน้ำหนัก) ดังต่อไปนี้ Cr 24.8; Ni 19.1; C 0.069; Si 0.75; Mn 1.37; P 0.036; S<0.001; O 0.013; Cu 0.07; Al 0.07; Ti 0.010; N 0.062 สมดุล มวลกับ Fe ลักษณะพื้นผิวของแผ่นตะแกรงแสตนเลส 310S ที่ยังไม่ได้เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา ถูกวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ปรากฏลักษณะพื้นผิวค่อนข้างเรียบ ดังนั้นใน งานวิจัยในลำดับถัดไปอาจจะต้องพิจารณาวิธีการที่จะทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถยึดเกาะได้ดี บนวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อความคงทนของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาบนพื้นผิวของวัสดุรองรับ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสได้ดียิ่งขึ้น



รูปที่ 4.3 รูปแบบ XRD แสดงโครงสร้างเฟสและผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด (a) TiO₂ (b) TiO₂/SiO₂ และ (c) SiO₂ (Tanongsak, 2020)



รูปที่ 4.4 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาค EDS เพื่อแสดงตำแหน่งของธาตุและองค์ประกอบธาตุในตัวเร่ง ปฏิกิริยาแต่ละชนิด (Tanongsak, 2022)



รูปที่ 4.5 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ของพื้นผิวแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ก่อนทำการเคลือบ ตัวเร่งปฏิกิริยา<mark>ที่กำ</mark>ลังขยายขนาดต่าง ๆ (Tanongsak, 20</mark>22)

การศึกษาความหยาบผิวหลังทำการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ รวมถึงไม่เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาลงบนพื้นผิววัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ลักษณะของความ หยาบบนพื้นผิวสามารถแสดงเป็นค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้วิเคราะห์ความหยาบบนพื้นผิว ได้แก่ *Sa Sku Sp Sq Ssk Sv* และ *Sz* ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่าการเคลือบ ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ปรากฏความหยาบบนพื้นผิวสูงสุด โดยที่ค่าเฉลี่ยของความหยาบนิว (arithmetical mean height; *Sa*) มีค่าประมาณ 1322 นาโนเมตร ค่าเฉลี่ยของรากที่สองของ ความหยาบผิว (root mean square length of the scale limited surface; *Sq*) มีค่าประมาณ 1556 นาโนเมตร รวมถึงปรากฏค่าความสูงสูงสุด (maximum peak height; *Sp*) และค่าความลึก สูงสุด (maximum peak height: *Sv*) และยังพบว่าความหยาบผิวขนาดโดยเฉลี่ย (maximum height of the scale limited surface; *Sz*) แสดงค่าสูงกว่าการเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และพื้นผิวที่ไม่ได้เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างเห็นได้ชัด ความไม่สมมาตรหรือการแจกแจงแบบเกาส์ เซียนถูกวิเคราะห์โดยพารามิเตอร์ความเบ้ของพื้นผิว (skewness of the scale limited surface; *Ssk*) โดยที่ค่า *Ssk* มีค่าบวกหมายถึงพื้นผิวมีความแหลมคมค่อนข้างสูงที่ยื่นออกมานอกระนาบพื้นผิว เฉลี่ย ในทางตรงกันข้ามเมื่อค่า *Ssk* มีค่าลบหมายถึงบริเวณพื้นผิวมีความลึกลงไปจากระนาบพื้นผิว เฉลี่ย (Vilas, 2007) ค่าความหยาบผิวเฉลี่ยรูปร่าง (kurtosis of the scale limited surface; *Sku*) หมายถึงการวัดรูปแบบความหยาบ เมื่อค่า (*Sku* < 3) คือ การกระจายความสูงเบ้เหนือระนาบเฉลี่ย (*Sku* = 3) คือ การกระจายความสูงเป็นแบบปกติ (Normal distribution) ส่วนค่า (*Sku* > 3) คือ การกระจายความสูงเป็นลักษณะหนามแหลม ดังแสดงในรูปที่ 4.6 แสดงลักษณะพื้นผิวความหยาบ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวที่ไม่ได้เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ 310.981 นาโนเมตร เมื่อเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ มีค่าเท่ากับ 365.391 และ 1322.001 นาโนเมตร ตามลำดับ ดังนั้นการเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ปรากฏความหยาบ

บนพื้นผิวสูงสุด อันเนื่องมาจากผลของรูพรุนที่ปรากฎบนโครงสร้างพื้นผิวของ SiO₂ ที่สังเคราะห์ได้ รูปที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ความหนาของชั้นฟิล์ม ตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันระหว่าง TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ด้วยวิธีการจุ่มเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา ลงบนแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S พบว่าความหนาของชั้นฟิล์มมีค่าเท่ากับ 2.7325 และ 4.7856 ไมโครเมตร ตามลำดับ โดยความหนาของชั้นฟิล์มพิจารณาจากระนาบแกนสามมิติ ได้แก่ ระนาบแกน x y และ z โดยที่ค่าในระนาบแนวแกน z จะแทนความหนาของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ อันเนื่องมาจากผลของ ชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ มีค่ามากกว่าชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ อันเนื่องมาจากผลของ ลักษณะรูพรุนบนพื้นผิวและขนาดอนุภาคของ SiO₂ ที่ได้เติมลงในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂

รูปที<mark>่</mark> 4.8 แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy; SEM) แสดงลักษณะทางสัณฐาน ้วิทยาของผลึก TiO₂ ค่อ<mark>นข้า</mark>งเร<mark>ียบไม่ปร</mark>ากฏรูพรุนบนพื้นผิวตัวเร่งป</mark>ฏิกิริยา โดยที่ขนาดอนุภาคผลึก เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 16.13 ไมโครเมตร (รูปที่ 4.8(a.1-4)) เมื่อทำการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ้แสดงลักษณะทางสัณฐานวิ<mark>ทยาปรากฏโครงสร้างรูพรุนที่กระจายตั</mark>วบนแผ่นตะแกรงสแตนเลส 3105 โดยที่ขนาดอนุภาคเฉลี่ยมีค่าเ<mark>ท่ากับ 1</mark>4.47 <mark>ไมโครเมตร ข</mark>นาดรูพรุนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 372.88 นาโนเมตร (รูปที่ 4.8(b.1-4)) ดังที่ได้กล่าวไว้ในผลการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ รูพรุนเหล่านี้เกิดจากการ ้เผาไหม้แกลบเพื่อขจัดโมเลกุลของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ออกไปเป็นสารละเหย ดังนั้นจึงปรากฏ รูพรุนบนพื้นผิวของ SiO2 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ทำให้เห็นปัญหาที่เกิดจากการเตรียมตัวเร่ง ปฏิกิริยาผสมระหว่าง SiO₂ (สถานะของแข็ง) และ TiO₂ (สถานะของเหลว) ในขั้นตอนการสังเคราะห์ ้ตัวเร่งปฏิกิริยาก่อนทำการเคลือบด้วยความต่างของสถานะของสารทั้งสองนี้ ส่งผลทำให้การผสมสาร เป็นเนื้อเดียวกันทำได้ยาก ทำให้ลักษณะชั้นฟิล์มที่ถูกเคลือบบนพื้นผิววัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ้มีลักษณะแตกร้าวและไม่สม่ำเสมอ บ่งบอกถึงลักษณะการเคลือบที่ไม่ดี ดังนั้นในการวิจัยในลำดับ ถัดไปจะต้องพิจารณาความหนืดของสารที่สังเคราะห์เพื่อลดการตกตะกอนของ SiO₂ ในสารละลาย โฟโตคะตะลิสต์ อีกทั้งต้องพิจารณาขนาดอนุภาคและสัดส่วนที่เหมาะสมของ SiO2 เพื่อเพิ่มการ ยึดเกาะให้แข็งแรงและป้องกันชั้นฟิล์มของตัวเร่งปฏิกิริยาหลุดลอกจากพื้นผิวของวัสดุรองรับ ตัวเร่งปฏิกิริยา

	พารามิเตอร์ความหยาบบนพื้นผิว									
ตัวอย่าง	Sa	Sku	Sp	Sq	Ssk	Sv	Sz			
(310S)	(nm)	-	(nm)	(nm)	-	(nm)	(nm)			
ไม่เคลือบ	310.981	10.426	1378.222	439.913	-1.978	-3415.035	4793.257			
เคลือบ TiO ₂	365.391	4.915	2230.068	501.739	0.520	-2293.282	4523.350			
เคลือบ TiO ₂ /SiO ₂	1322.001	2.093	3938.382	1556.645	0.192	-3479.549	7417.930			

ตารางที่ 4.1 ค่าพารามิเตอร์แสดงความหยาบบนพื้นผิวแบบ 2 และ 3 มิติ



รูปที่ 4.6 ลักษณะความหยาบของพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (a) ไม่เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา (b) เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และ (c) เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ (Tanongsak, 2022)



รูปที่ 4.7 ลักษณะความหนาของชั้นฟิล์มหลังเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา (a) TiO₂ (b) TiO₂/SiO₂ (Tanongsak, 2022)



รูปที่ 4.8 ลักษณะพื้นผิวที่วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) หลังทำการ เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ บนแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S (Tanongsak, 2022)

4.1.2 การทดสอบเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสสำหรับการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

4.1.2.1 ผลกระทบของตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่าง TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ในการ สังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂

รูปที่ 4.9 แสดงเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิสกับ ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ โดยที่ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้แหล่งกำเนิดแสง อัลตราไวโอเลต ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่ากับ 60% RH อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ เท่ากับ 30°C ความเร็วของอากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 8.2 เมตรต่อวินาที ชนิดของตัวเร่ง ปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ได้ทำการทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ที่จัดทำขึ้น ในงานวิจัยที่สภาวะเดียวกันจำนวนทดสอบซ้ำสามครั้ง เพื่อประเมินความคงที่ของเครื่องปฏิกรณ์ โฟโตคะตะไลซิสที่ใช้ในการทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากการทดสอบพบว่าเครื่องปฏิกรณ์ ที่จัดทำขึ้นสามารถสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ทั้งสามการทดลองให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีค่าใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นในการทดสอบผลกระทบของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในลำดับถัดไปจะทำการทดสอบเพียง <u>1 ครั้งต่อการทดลอง</u>ที่สภาวะนั้น ๆ



รูปที่ 4.9 การทดสอบความคงที่ของเครื่องปฏิกรณ์ในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ (Tanongsak, 2022)

รูปที่ 4.10 แสดงเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสกับ ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้แหล่งกำเนิดแสงและปราศจาก แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่ากับ 60% RH อุณหภูมิภายในเครื่อง ปฏิกรณ์เท่ากับ 30℃ ความเร็วของอากาศเท่ากับ 5.1 เมตรต่อวินาที โดยทำการเปรียบเทียบ ้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ รวมถึงปราศจากตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบที่ปราศจากตัวเร่งปฏิกิริยาและแหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ไม่ควรมีความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่เกิดจากปฏิกิริยาแต่ในผลการทดลองสามารถวัดค่าความเข้มข้น ของก๊าซ H2O2 ได้ในระดับความเข้มข้นต่ำ อันเนื่องมาจากแท้ที่จริงแล้วก๊าซ H2O2 สามารถพบได้ทั่วไป ในสิ่งแวดล้อม (Willey, 1999; Price, 1992; Szymczak, 1991; Weller, 1993; Halliwell, 2000) ้ดังนั้นจึงทำให้ในการทดลองยังสามารถวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ได้ เมื่อดำเนินปฏิกิริยาครบ ้สามองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและ สารตั้งต้น (ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศกล่าวถึง<mark>โม</mark>เลกุลของน้ำ (H₂O) และออกซิเจน (O₂)) พบว่าระดับ ้ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้เพิ่<mark>มขึ</mark>้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ้ตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่าง TiO₂ และ TiO₂/S<mark>iO₂ พบ</mark>ว่าตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ สามารถสังเคราะห์ ้ก๊าซ H₂O₂ได้ระดับความเข้มข้นสูงกว่าที่สภาวะเดียวกัน จะเห็นได้ว่า SiO₂ ช่วยเพิ่มกิจกรรมใน ้กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เนื่องจาก<mark>ก</mark>ารทำง<mark>า</mark>นร่วมกันระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ ภายใต้แหล่ง ้กำเนิดแสงอัลตราไวโอเลตแสดงกลไก<mark>การ</mark>ทำงานร่ว<mark>มกัน</mark>ดังแสดงในรูปที่ 4.11 การเพิ่ม SiO₂ ในตัวเร่ง ้ปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิ<mark>ว</mark>จำเพาะให้กับตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างมีนัยสำคัญลักษณะพื้นผิวที่มี ้รูพรุนจำนวนมากช่วยให้สารตั้ง<mark>ต้นม</mark>ีพื้นที่ในการเกิดปฏิ<mark>กิริย</mark>ามากขึ้นบนพื้นผิว อีกทั้งยังช่วยในการ ้ดึงดูดโมเลกุลของออกซิเจน (O2) และโมเลกุลของน้ำ (H2O) ให้เข้าใกล้พื้นผิวที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2 ตามคุณสมบัติความชอบน้ำของ SiO₂ ดังนั้นจึงทำให้มีโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ มากกว่าตัวเร่งปฏ<mark>ิกิริย</mark>า TiO₂ เพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการวิจัยในลำดับถัดไปจะต้องศึกษา ้สัดส่วนระหว่าง TiO₂ ต่<mark>อ SiO</mark>2 เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุ<mark>ดในกา</mark>รสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการสังเค<mark>ราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ใ</mark>นอากาศ อีกทั้งยังต้องศึกษากลไก เชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของ SiO₂ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสโดยเน้นที่ SiO₂ ที่ถูกสังเคราะห์มา จากแกลบข้าวเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติต่าง ๆ

4.1.2.2 ผลกระทบของความขึ้นสัมพัทธ์ในอากาศในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ TiO₂/SiO₂

รูปที่ 4.12 แสดงเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสกับ ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 30°C ความเร็วของอากาศเท่ากับ 5.1 เมตรต่อวินาที ชนิดของ ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ โดยทำการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 40 50 60 และ 70% RH จากการทดสอบพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมและให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ สูงสุดคือความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเท่ากับ 60% RH แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศที่ 70% RH ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีแนวโน้มลดลง ในทำนองเดียวกันเมื่อ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศต่ำกว่า 60% RH รูปที่ 4.13 จำลองกลไกการดูดซับความชื้นที่ค่าความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศต่าง ๆ ที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 60% RH พบการดูดซับโมเลกุลของน้ำบนพื้นผิว หรือเกิดการดูดซับภายในรูพรุนของ SiO₂ จากการที่จำนวนโมเลกุลของน้ำที่น้อยเกินไปส่งผลให้เกิด การดูดซับในรูพรุนและเกิดการสลายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ ก่อนออกจากเครื่องปฏิกรณ์ ส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่วัดได้มีค่าความเข้มข้นค่อนข้างต่ำ (รูปที่ 4.13(a)-(b)) เมื่อ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่ากับ 60% RH รูพรุนของ SiO₂ เต็มไปด้วยโมเลกุลของน้ำโมเลกุลเหล่านี้ มีปริมาณเหมาะสมในการดูดซับบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาและการแตกตัวเพื่อสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงจึงทำให้ปรากฏความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ สูงสูดที่ความชื้นสัมพัทธ์ 60% RH (รูปที่ 4.13(c)) เมื่อความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 70% RH เกิดการควบแน่นโมเลกุลของน้ำบนพื้นผิวตัวเร่ง ปฏิกิริยาทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิล์มบาง ๆ ที่กั้นระหว่างพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาและแสงที่ถูกฉายมาจาก แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ดังนั้นจึงผลให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีค่า ลดลง (รูปที่ 4.13(d)) ในการศึกษาในงานวิจัยในลำดับถัดไปจะต้องศึกษาผลกระทบของความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศที่ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงแคบ เพื่อทำให้ทราบกลไกของผลกระทบของความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศที่นการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ อีกทั้งศึกษาผลกระทบของความชื้นสัมพันธ์ใน อากาศในช่วงที่มากกว่า 70% RH และต่ำกว่า 40% RH เพื่อยืนยันแนวโน้มผลการทดลองดังกล่าว



รูปที่ 4.10 ผลกระทบขององค์ประกอบสำคัญในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (Tanongsak, 2022)



รูปที่ 4.11 การจำลองกลไกการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ร่วมกับ ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ (Tanongsak, 2022)



รูปที่ 4.12 ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิส (Tanongsak, 2022)

4.1.2.3 ผลกระทบของความเร็วของอากาศในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ร่วมกับ ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂

รูปที่ 4.14 แสดงเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิสกับ ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 30°C ความชิ้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่ากับ 60% RH ชนิดของ ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ โดยทำการเปรียบเทียบความเร็วของอากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์ ได้แก่ 5.1 6.5 7.4 และ 8.2 เมตรต่อวินาที จากผลการทดสอบพบว่าเมื่ออัตราการไหลของอากาศเพิ่มขึ้น แนวโน้มความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มความเร็วของ อากาศส่งผลให้โมเลกุลของน้ำและออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นอัตราการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จึงเพิ่มสูงขึ้น ความเร็วของอากาศที่เพิ่มขึ้นช่วยลดการเกิดชั้นฟิล์มของน้ำบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางโฟโตคะตะไลซิสได้ดียิ่งขึ้น ในการศึกษาในลำดับถัดไปจะต้อง ศึกษาช่วงของความเร็วของอากาศที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าผลการทดลองในส่วนนี้จะให้ผลว่าการเพิ่ม ความเร็วของอากาศที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าผลการทดลองในส่วนนี้จะให้ผลว่าการเพิ่ม ให้ทราบความเร็วของอากาศที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ แต่อย่างไรก็ตามความเร็ว ของอากาศที่เร็วเกินไปอาจส่งผลต่อระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นจำเป็นต้องศึกษาต่อเพื่อ ให้ทราบความเร็วของอากาศที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ที่ดีที่สุดในกระบวนการโฟโตคะ ตะไลซิส



รูปที่ 4.13 จำลองกลไกการดูดซับโมเลกุลของน้ำที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่แตกต่างกันโดยที่ โมเลกุลอิสระของน้ำถูกดูดซับเป็นจำนวนมากบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา (Tanongsak, 2022)



รูปที่ 4.14 ผลกระทบของความเร็วขอ<mark>งอา</mark>กาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะ ตะไลซิส (Tanongsak, <mark>20</mark>22)

4.2 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

หัวข้อนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เพื่อหาสภาวะ การทำงานที่เหมาะสมของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับสังเคราะห์ก้าซ H₂O₂ จากความขึ้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ปัจจัย ได้แก่ ความขึ้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความเร็วของอากาศ ขนาดอนุภาคของ SiO₂ และสัดส่วนระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด TiO₂/SiO₂ ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษาดังกล่าวได้แสดงในหัวข้อต่อไปนี้

4.2.1 ผลกระทบของความขึ้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

รูปที่ 4.15 แสดงเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสกับความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้โดยที่ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในช่วง 30-35℃ ความเร็วของอากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์ เท่ากับ 8.2 เมตรต่อวินาที ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ระยะเวลาในการดำเนินปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง ทำการศึกษาผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศในช่วงที่แตกต่างกัน ได้แก่ 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 และ 75-80% RH ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบว่าช่วง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่แตกต่างกันและระยะเวลาในการดำเนินปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ จากการศึกษาผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์

ในอากาศเบื้องต้น ในส่วนของการประเมินความเป็นไปได้ของงานวิจัย ในหัวข้อย่อย 4.1.2.2 ระดับ ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีช่วงความเข้มข้นที่แตกต่างกัน เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับวัดก๊าซ H₂O₂ แจ้งขอทำการทดสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ จึงส่งผล ให้ระดับความเข้มข้นของก๊าซ H2O2 ที่วัดได้จากการทดลองก่อนหน้าและในหัวข้อนี้แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามผลการทดลองที่ได้ทำการศึกษา ปรากฦแนวโน้มเดียวกันกับการผลทดลองก่อนหน้า ้ดังนั้นผู้วิจัยจะอ้างอิงระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่วัดได้จากผลการศึกษาในหัวข้อ 4.2 เป็น หลัก จากผลการศึกษาพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ 60-65% RH จากรูปที่ 4.16(c) ปรากฏค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ เมื่อเฉลี่ยที่เวลา 60 ถึง 120 นาที ที่ความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศแตกต่างกันได้แก่ 35-40 40-45 45<mark>-5</mark>0 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 และ 75-80% RH มีค่าเท่ากับ 0.15 0.25 0.77 1.12 0.9<mark>9 1</mark>.21 0.73 0.88 และ 0.81 ppmv ตามลำดับ หาก ้พิจารณาที่ช่วงเวลา 0 ถึง 30 นาที ในช่วงนี<mark>้เกิดปร</mark>ากฏการณ์ที่โมเลกุลของน้ำในอากาศค่อย ๆ สะสม ้ตัวบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจึงป<mark>ร</mark>ากฏร<mark>ะ</mark>ดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มี ์ แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 20 นาทีแรกของทุกช่วงค<mark>ว</mark>ามชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่าง ๆ เมื่อเฉลี่ยค่าความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ช่วง 30 นาทีแร<mark>กมีค่าเท่ากับ 0.4</mark>2 0.72 0.63 1.37 1.62 1.18 1.19 1.12 และ 1.68 ppmv ตามลำดับ (รูปที่ 4.16(a)) ระดับความเชิ่มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีค่าแกว่งขึ้น ้ลงเล็กน้อย เนื่องจากช่วงความ<mark>ชื้น</mark>สัมพัทธ์ในอากาศท<mark>ี่ได้</mark>ทำการศึกษามีช่วงความชื้นที่พิจารณา ้ค่อนข้างแคบ หากพิจารณาที่ค<mark>ว</mark>ามชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเมื่อร<mark>ะ</mark>ยะเวลาดำเนินปฏิกิริยาในช่วง 30 ถึง 60 นาที ปรากฏระดับควา<mark>มเข้</mark>มข้<mark>นของก๊าซ H₂O2 ที่สังเค</mark>ราะห<mark>์ได้</mark>มีแนวโน้มต่ำกว่าช่วงเวลา 0 ถึง 30 ้นาที มีค่าเท่ากับ 0.19 <mark>0.64</mark> 0.77 1.11 1.42 1.08 0.74 1.29 และ 1.12 ppm∨ ตามลำดับ (รูปที่ 4.16(b)) ผลกระทบดังก<mark>ล่าวเกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาได้รับพ</mark>ลังง<mark>านจาก</mark>แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต ้เป็นระยะเวลานานขึ้น ส่ง<mark>ผลให้ปริมาณการปลดปล่อยอิเล็กตรอน</mark>และโฮลบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ้เพิ่มมากขึ้น ในทำนองเดียวกั<mark>นปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสเป็นป</mark>ฏิกิริยาที่ไม่เสถียรสามารถผันกลับได้ ดังนั้นโอกาสของโมเลกุลของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จึงมีโอกาสสลายตัวด้วยหลายปัจจัย อาทิเช่น การสลายตัวเนื่องจากการกลับมารวมตัวใหม่กับอิเล็กตรอนในระบบ การสลายตัวภายใต้แหล่งกำเนิด ู้แสง และการสลายตัวเนื่องด้วยความไม่เสถียรทางโครงสร้างเคมี เป็นต้น จึงส่งผลให้แนวโน้มค่าความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ลดลง หากจำลองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ดังแสดงในรูปที่ 4.17 เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงกว่า 65% RH พบปรากฏการณ์การควบแน่นโมเลกุลของน้ำในอากาศบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นหลัก ้ส่งผลทำให้เกิดชั้นฟิล์มของน้ำเคลือบบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งทำหน้าที่เสมือนชั้นฟิล์มกั้นระหว่าง ้พื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา (บริเวณปลดปล่อยอิเล็กตรอน (e^{\cdot}) และโฮล (h^{\star})) กับแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ้อัลตราไวโอเลต (hv) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ส่งผลให้ประสิทธิภาพ ในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ลดลงเมื่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเกินไป ดังแสดงในรูปที่ 4.17(a) เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำกว่า 50% RH พบผลกระทบของการสลายตัวของก๊าซ H₂O₂
ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงและการกลับมารวมตัวใหม่กับอิเล็กตรอนเป็นหลัก เนื่องจากระดับความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีความเข้มข้นต่ำตามปริมาณโมเลกุลของน้ำในอากาศที่เข้าไปใน ระบบ เมื่อเกิดผลกระทบดังกล่าวจึงส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ลดลงอย่างมากที่ ระยะเวลาดำเนินปฏิกิริยามากกว่า 60 นาที (รูปที่ 4.17(c)) เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ในช่วง 50-65% RH ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำกว่า 50% RH เพียงแต่ว่า ปริมาณของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณมากกว่า เมื่อเทียบกับอัตราการสลายตัวของก๊าซ H₂O₂ ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงในตอนต้น จึงปรากฏระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณสูงกว่าและระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้อยู่ในระดับ ค่อนข้างคงที่ดังแสดงในรูปที่ 4.17(b)



รูปที่ 4.15 ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิส



รูปที่ 4.16 ผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิสเมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่แตกต่างกัน



รูปที่ 4.17 กลไกของผลกระทบจากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ (a) สูงกว่า 65% RH (b) 50-65% RH และ (c) ต่ำกว่า 50% RH

4.2.2 ผลกระทบของความเร็วของอากาศสำหรับการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วย กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

รูปที่ 4.18 แสดงเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสกับความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้โดยที่ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในช่วง 30-35℃ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่ากับ 60-65% RH ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ระยะเวลาในการดำเนินปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง ทำการศึกษา ผลกระทบของความเร็วของอากาศในช่วงที่แตกต่างกัน ได้แก่ 6.1 8.2 11.0 12.0 และ 13.4 เมตรต่อ ้วินาที ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบว่าความเร็วของอากาศที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H2O2 มีค่าเท่ากับ 12.0 เมตรต่อวินาที โดยที่ค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ มีค่าเท่ากับ 1.69 ppmv (รูปที่ 4.18(b)) นอกจากนั้นยังพบว่าการเพิ่มความเร็วของอากาศ ส่งผลให้แนวโน้มความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้เพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 4.18(a.1-2)) อันเนื่องมาจากความเร็วของ อากาศลดการสะสมตัวของชั้นฟิล์มของโมเลกุลน้ำในอากาศบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งช่วยให้พื้นผิว ้ตัวเร่งปฏิกิริยาสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงทำ<mark>ให้</mark>เพิ่มประสิทธิภาพการปลดปล่อยอิเล็กตรอนและโฮ ้ลในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสมากขึ้น อีก<mark>ทั้ง</mark>ลดการสลายตัวของก๊าซ H₂O₂ ภายในเครื่องปฏิกรณ์ ้จากปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น การสลายตัวภ<mark>ายใต้แห</mark>ล่งกำเนิดแสง และลดการกลับมารวมตัวใหม่กับ ้อิเล็กตรอน แต่อย่างไรก็ตามความเร็วข<mark>อ</mark>งอาก<mark>า</mark>ศที่เพิ่มสูงขึ้นมากเกินไป พบผลกระทบเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาภายในเค<mark>รื่</mark>องปฏิ<mark>ก</mark>รณ์ ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ู้ที่สังเคราะห์ได้มีแนวโน้มลดลงเมื่อควา<mark>มเร</mark>็วของอาก<mark>าศสู</mark>งกว่า 12.0 เมตรต่อวินาที เมื่อทำการเฉลี่ยค่า ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.66 1.17 1.32 1.69 และ 0.94 ppm∨ ตามลำดับ (รูป<mark>ที่ 4</mark>.18(b))

4.2.3 ผลกระทบของขนาดอนุภาค SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ สำหรับ สังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

รูปที่ 4.19 แสดงเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิสกับความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้โดยที่ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในช่วง 30-35°C ความชิ้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่ากับ 60-65% RH ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ สัดส่วนระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ เท่ากับ TiO₂/1%SiO₂ ความเร็วของอากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 12.0 เมตรต่อวินาที ระยะเวลาใน การดำเนินปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง ทำการศึกษาผลกระทบของขนาดอนุภาคของ SiO₂ ในช่วงขนาด ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขนาดต่ำกว่า 38 ไมโครเมตร ช่วงขนาด 45-53 53-63 และ 63-75 ไมโครเมตร จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบที่ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ พบว่าขนาดอนุภาคของ SiO₂ ต่ำกว่า 38 ไมโครเมตร สามารถสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ได้ค่าความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 1.84 ppmv ดังแสดงในรูปที่ 4.19(b) แต่อย่างไรก็ตามระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ที่ช่วง ขนาดอนุภาคของ SiO₂ ต่ำกว่า 38 ไมโครเมตร และช่วงขนาดอนุภาคของ SiO₂ เท่ากับ 45-53 และ 53-63 ไมโครเมตร มีค่าเท่ากับ 1.84 1.76 และ 1.71 ppmv ซึ่งให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ไม่ได้แตกต่างกันมาก ดังนั้นในการศึกษาฉัดไป จึงพิจารณาขนาดอนุภาคของ SiO₂ ที่ช่วงขนาดอนุภาค ต่ำกว่า 63 ไมโครเมตร แนวโน้มของความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่เพิ่มขึ้นตามช่วงขนาดอนุภาคของ SiO₂ ที่เล็กลง อันเนื่องมาจากพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาบนพื้นผิวที อุดมไปด้วยอนุภาค TiO₂ บนพื้นผิว SiO₂ จึงมีมากขึ้น หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวเร่ง ปฏิกิริยา TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ดังแสดงในรูปที่ 4.19(a.1-2) พบว่าคุณสมบัติของ SiO₂ ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสมากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ เพียงอย่างเดียว ค่าความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ มีค่าเท่ากับ 1.69 ppmv นอกจากนี้ ขนาดอนุภาคของ SiO₂ ที่ใหญ่กว่า 63 ไมโครเมตรพบปัญหาการยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุรองรับตัวเร่ง ปฏิกิริยา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเกิดขึ้นบนพื้นผิว วัสดุรองรับที่ถูกเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ไม่ดี



รูปที่ 4.18 ผลกระทบของความเร็วของอากาศสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะ ตะไลซิส (a) ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ ตามเวลาการเกิดปฏิกิริยา (b) ความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.19 ผลกระทบของขนาดอนุภาค SiO₂ สำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะ ตะไลซิส (a) ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ ตามเวลาการเกิดปฏิกิริยา (b) ความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

4.2.4 ผลกระทบของสัดส่วนระหว่าง TiO₂ กับ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ สำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

รูปที่ 4.20 แสดงเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสกับความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ที่สังเคราะห์ได้ โดยที่ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UVC) อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์อยู่ในช่วง 30-35℃ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเท่ากับ 60-65% RH ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ความเร็วของอากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 12.0 เมตรต่อวินาที ขนาดอนุภาคของ SiO₂ ต่ำกว่า 63 ไมโครเมตร ระยะเวลาในการดำเนินปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง ทำการศึกษาผลกระทบของสัดส่วนระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ โดยที่สัดส่วนแตกต่างกัน ได้แก่ TiO₂ TiO₂/1%SiO₂ TiO₂/3%SiO₂ TiO₂/5%SiO₂ TiO₂/7%SiO₂ TiO₂/10%SiO₂ และ TiO₂/20%SiO₂ ตามลำดับ จากผลการทดลองก่อนหน้าในหัวข้อ 4.2.3 พบว่า การเติม SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ให้แนวโน้มในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ที่ดีกว่าตัวเร่ง ปฏิกิริยา TiO₂ เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากคุณสมบัติทางด้านพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ผล การศึกษาสัดส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/SiO2 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ SiO2 ที่เติมลงไปในตัวเร่ง ้ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นให้ผลการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ มีแนวโน้มลดลงถึงแม้พื้นที่ผิวจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณ ของ SiO2 ที่เติมในตัวเร่งปฏิกิริยา (รูปที่ 4.20(a.1-2)) ผลกระทบของ SiO2 ที่เติมลงไปส่งผลต่อแถบ ช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/SiO2 ถึงแม้ว่าความน่าจะเป็นทางคุณสมบัติทางพื้นผิวควร ้จะดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากแถบ<mark>ช่อ</mark>งว่างพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นตัวหลักในการกำหนด ้กิจกรรมทางโฟโตคะตะไลซิส หรือกล่าวอีกนั<mark>ยห</mark>นึ่งคือต้องใช้พลังงานสูงขึ้นในการกระตุ้นอิเล็กตรอน จากแถบวาเลนซ์ (valence band; VC) ไปยังแถบนำไฟฟ้า (conduction band; CB) (รูปที่ 4.17) ้ดังนั้นสัดส่วนที่เหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่าง TiO2/SiO2 ในการศึกษาของงานวิจัยนี้ คือ TiO₂/1%SiO₂ ซึ่งสามารถสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ มีความเข้มข้นเท่ากับ 1.82 ppmv (รูปที่ 4.20(b)) อีกทั้งการเพิ่มปริมาณของ SiO2 ส่ง<mark>ผลต่</mark>อการยึ<mark>ดเก</mark>าะบนพื้นผิวของวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ้กล่าวคือเมื่ออนุภาคของแข็งเพิ่มขึ้นใ<mark>นสา</mark>รล<mark>ะลายโฟโตคะต</mark>ะลิสต์ส่งผลให้การเคลือบและการยึดเกาะ ้บนพื้นผิวได้ไม่ค่อยดีและเกิดกา<mark>รหล</mark>ุดของอนุภาค SiO₂ หลังทำการเคลือบ หากในการศึกษาต่อไป สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุรอง<mark>ร</mark>ับตัวเร่งปฏิกิริยาอาจจะพบสัดส่วนที่เหมาะสมของ SiO₂ ที่ดีกว่า TiO₂/1%SiO₂ แต่อย่างไรก็ต[้]ามในการศึกษานี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นเปร<mark>ีย</mark>บเทียบสัดส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ถูกเคลือบลงบนแผ่นตะ<mark>แกร</mark>งส<mark>แตนเลส 3105 ส่วนการศึกษาผลกร</mark>ะทบของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ สำหรับสังเค<mark>ราะห์ก้าซ H₂O₂ จะกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งในหัวข้อ 4.3</mark>

จากผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก้าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส พบว่าสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เท่ากับ 60-65% RH ความเร็วของอากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 12.0 เมตรต่อวินาที ขนาด อนุภาคของ SiO₂ ต่ำกว่า 63 ไมโครเมตร สัดส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ ได้แก่ TiO₂/1%SiO₂ สามารถสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ได้ค่าความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 1.82 ppmv



รูปที่ 4.20 ผลกระทบของสัดส่วนระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ สำหรับ สังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (a) ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ ตามเวลาการเกิดปฏิกิริยา (b) ความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซ H₂O₂ ที่ สังเคราะห์ได้ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

4.3 บทบาทของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ สำหรับกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิส

หัวข้อนี้ได้ทำการศึกษาผลกระทบของการเติม SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/SiO₂ เพื่อศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส โดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ขั้นสูงทำการศึกษาผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีของ SiO₂ ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษา ดังกล่าวได้แสดงในหัวข้อต่อไปนี้

4.3.1 ผลกระทบของ SiO₂ ต่อโครงสร้างเฟสและขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย แสง TiO₂/SiO₂

จากรูป 4.21 การศึกษาโครงสร้างเฟสและขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ชนิด SiO₂ TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ที่สัดส่วนของ SiO₂ แตกต่างกัน โดยใช้เทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบน ของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction; XRD) ผลการศึกษาแสดงรูปแบบ XRD ของ SiO2 ปรากฏโครงสร้าง แบบอสัณฐาน (amorphous SiO₂) อ้างอิงรูปแบบผลึกสามมิติ (hexagonal, space group P6/ mmm (191)) ดังแสดงโครงสร้างดังรูปที่ 4.22(c) พบตำแหน่งพีคที่ 20 เท่ากับ 22° (รูปที่ 4.21) ในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO2 ปรากฏสองโครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างอนาเทสและ รูไทล์ สำหรับโครงสร้างอนาเทสของ TiO₂ <mark>อ้า</mark>งอิงตามมาตรฐาน ICSD หมายเลข 98-017-2916 (tetragonal, space group 141/amd (141)<mark>) ดั</mark>งแสดงโครงสร้างสามมิติในรูปที่ 4.22(b) พบตำแหน่ง พิคที่ 2**6** เท่ากับ 25.3° 37.8° 48.0° 53.9<mark>° 55.0°</mark> 62.7° 68.0° 70.3° และ 75.1° ซึ่งสอดคล้องกับ ระนาบผลึก 011 004 020 015 121 024 116 220 และ 125 ตามลำดับ ในส่วนโครงสร้างรูไทล์ของ TiO₂ อ้างอิงตามมาตรฐาน JCPDS หมา<mark>ย</mark>เลข 21-1276 (tetragonal , space group P42/mnm (136)) พบตำแหน่งพีคที่ 2*θ* มีค่าเท่<mark>ากับ</mark> 27.4° 3<mark>6.1°</mark> 39.2° 41.2° 44.0° 54.3° 56.6° 62.7° 64.0° 69.0° และ 69.8° ซึ่งสอดคล้องกับระนาบผลึก 110 101 200 111 210 211 220 002 310 301 และ 112 ตามลำดับ สำหรับตัวเร่งป<mark>ฏิกิ</mark>ริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/SiO₂ ที่สัดส่วนของ SiO₂ แตกต่างกัน ้ปรากฏโครงสร้างอสัณฐานจาก SiO₂ และโครงสร้างอนาเทสและรูไทล์จาก TiO₂ ปะปนอยู่ จะเห็นได้ ้ชัดว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ แสดงแนวโน้มของโครงสร้าง ้เฟสผลึกแบบอนาเทสเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สังเคราะห์ได้นั้นแสดง โครงสร้างรูไทล์เป็นหลั<mark>ก (รูปที่</mark> 4.21) การสัน<mark>นิษฐานโคร</mark>งสร้<mark>างสา</mark>มมิติของ TiO₂/SiO₂ ดังแสดงใน รูปที่ 4.22(d) การพิจารณ<mark>าขนาดผลึกจากเทคนิค XRD สามารถ</mark>คำนวณโดยใช้สมการเชอร์เรอร์ (Scherrer equation) ดังแสดงผลการคำนวณขนาดผลึกในตารางที่ 4.2 การเติม SiO₂ ช่วยลดขนาด ผลึกของ TiO2 และเพิ่มปริมาณเฟสผลึกแบบอนาเทส นอกจากนั้นขนาดผลึกของอนาเทสทั้งหมด มีขนาดเล็กกว่ารูไทล์อาจบ่งชี้ได้ว่าการเติม SiO₂ ลดการรวมตัวกันของเฟสผลึกแบบอนาเทสเป็นรูไทล์ โดยสังเกตที่ขนาดผลึกของรูไทล์ลดลงเมื่อเพิ่ม SiO2 ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kiyoshi Okada (2001) จากการวัดวิเคราะห์ขนาดผลึกด้วยวิธี SEM ให้ผลเช่นเดียวกันกับขนาดผลึกที่ลดลง ของ TiO2 เมื่อปริมาณของ SiO2 เพิ่มขึ้น อีกทั้งการเติม SiO2 ช่วยลดวิถีทางของอิเล็กตรอนและโฮล ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแสง เพื่อย้ายไปยังไซด์การทำงานบนพื้นผิวของ TiO₂ เพิ่มขึ้น อีกทั้งลดการกลับมา รวมตัวกันระหว่างอิเล็กตรอนและโฮลที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแสง ทำให้ TiO2/SiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสงที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ TiO2 และ SiO2 เพียงอย่างเดียวซึ่งให้ผลการวิจัยสอดคล้อง ้ กับงานวิจัยก่อนหน้า (Collin, 2021; Ramamoorthy, 2016; Balachadran, 2014) มากไปกว่านั้น โครงสร้างเฟสผลึกของ TiO2 แบบอนาเทสและรูไทล์ยังส่งผลต่อแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่ง ปฏิกิริยาด้วยแสงซึ่งจะกล่าวในลำดับถัดไป

ະ ເ ເ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ ຊ	ขนาดผลึก (นาโนเมตร)		
ตวเรงปฏ่กรียาด้วยแสง	อนาเทส	รูไทล์	อสัณฐาน
SiO ₂	-	-	0.627
TiO ₂	0.504	18.548	-
$TiO_2/1\%SiO_2$	1.560	20.407	0.171
TiO ₂ /3%SiO ₂	2.713	16.605	6.132
TiO ₂ /5%SiO ₂	2.729	16.552	6.214
TiO ₂ /7%SiO ₂	3.562	15.133	10.783
$TiO_2/10\%SiO_2$	2.958	10.642	10.679
TiO ₂ /20%SiO ₂	2.644	6.909	10.593

ตารางที่ 4.2 ขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง



รูปที่ 4.21 รูปแบบ XRD แสดงโครงสร้างเฟสและผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง



รูปที่ 4.22 รูปแบบโครงสร้างเฟสผลึก 3 มิติของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (a) TiO₂ รูไทล์ (b) TiO₂ อนาเทส (c) SiO₂ อสัณฐาน และ (d) TiO₂/SiO₂

4.3.2 ผลกระทบของ SiO₂ ต่อพื้นที่ผิวจำเพาะ ปริมาตรรูพรุน และขนาดรูพรุนของ ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂

จากรูปที่ 4.23 ทำการศึกษาผลกระทบของ SiO₂ ต่อพื้นที่ผิวจำเพาะ ปริมาตรรูพรุน และขนาดรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยใช้เทคนิคการดูดซับไนโตรเจนที่อุณหภูมิ -196.15°C หรือ 77 K คำนวณโดยใช้สมการ BET เพื่อหาค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂ TiO₂/1%SiO₂ TiO₂/3%SiO₂ TiO₂/5%SiO₂ TiO₂/7%SiO₂ TiO₂/10%SiO₂ TiO₂/20%SiO₂ และ SiO₂ จากผลการวิเคราะห์แสดงค่าพื้นที่ผิวจำเพาะเท่ากับ 13.25 26.64 35.05 40.54 57.97 69.87 99.36 และ 158.49 m²/g ตามลำดับ ปริมาตรรูพรุนมีค่าเท่ากับ 0.0641 0.1393 0.1668 0.1768 0.2121 0.2245 0.2529 และ 0.3091 cm³/g ตามลำดับ ขนาดรูพรุนมีค่าเท่ากับ 19.348 20.917 19.041 17.440 14.635 12.855 10.182 แล<mark>ะ</mark> 7.800 นาโนเมตร การเติม SiO₂ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิว ้จำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง อันเนื่อ<mark>งมาจาก</mark>สมบัติรูพรุนบนพื้นผิวของ SiO₂ ส่งผลให้มีพื้นที่ผิว ภายในต่อหนึ่งหน่วยมวลสูง คุณสมบัตินี้ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงและการแพร่กระจายตัวของโมเลกุล ้สารตั้งต้น (โมเลกุลของออกซิเจนและน้ำจากควา<mark>ม</mark>ชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ) บนพื้นผิวได้สูงขึ้น อีกทั้ง ้ขนาดรูพรุนที่มีขนาดเล็กบนพื้นผิวข<mark>อง S</mark>iO₂ ส่งผ<mark>ลให้</mark>มีปริมาตรรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เพิ่มขึ้นต่อหนึ่งหน่วยมวล ดังนั้นการเติม SiO2 ช่วยเพิ่มลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวเร่งปฏิกิริยา ้ด้วยแสง TiO₂/SiO₂ ทางกายภา<mark>พได้</mark>อย่างมีประสิทธิภา<mark>พ แ</mark>ต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล ของสารตั้งต้นไปเป็นสารผลิต<mark>ภัณฑ์</mark>ขึ้นอยู่กับไซต์ทำงานของ TiO₂ บนพื้นผิว การเพิ่ม SiO₂ ที่มาก ้เกินไปทำให้โอกาสที่โมเลกุ<mark>ลข</mark>องส<mark>ารตั้งต้นจะถูกดูดซับบน</mark>อนุภ<mark>าค</mark> TiO₂ น้อยลง ดังนั้นการที่พื้นที่ผิว ้จำเพาะเพิ่มสูงขึ้นไม่ได้เป็<mark>นตั</mark>วกำ<mark>หนดว่าปฏิกิริย</mark>าจะเกิดขึ้นได้ดีเพียง</mark>อย่างเดียว ดังแสดงในรูปที่ 4.20 พบสัดส่วนของ SiO₂ ที่<mark>เหมาะ</mark>สมเท่ากับ TiO₂/1%SiO₂ ที่สามารถสังเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ได้ดีที่สุด อีกหนึ่งปัจ<mark>จัยที่น่าสนใจกล่าวคือ การเพิ่ม SiO₂ ส่</mark>งผลให้การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา ้ด้วยแสงบนพื้นผิววัสดุรองรับ<mark>ทำให้ยึดเกาะได้ยากขึ้น เนื่อง</mark>จากผลกระทบของปริมาณ SiO₂ ที่มี อนุภาคขนาดเล็ก แต่ถ้ามองในด้านการยึดเกาะบนแผ่นตะแกรงสแตนเลสที่ไม่มีตัวเชื่อมต่อระหว่าง พื้นผิวแผ่นตะแกรงสแตนเลสและชั้นฟิล์มของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ถือว่าขนาดอนุภาคในระดับ ไมโครเมตรของ SiO2 ยังมีขนาดใหญ่จึงทำให้ยึดเกาะได้สูงสุดเท่าที่จะยึดเกาะได้ ถึงแม้ว่าพื้นที่ผิวจะ ้วัดได้จากการทดสอบการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนของ SiO₂ แต่พื้นที่ผิวที่ถูกเคลือบ อาจจะยึดเกาะได้ในปริมาณที่จำกัดจึงส่งผลให้แต่ละสัดส่วนของ SiO₂ ที่เติมลงไป เมื่อทดสอบการ ้สังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ระดับความเข้มข้นที่สังเคราะห์ได้ ไม่แตกต่างกันมากและมีแนวโน้มลดลงดังที่ได้ ้อธิบายผลกระทบไว้ในส่วนต้นว่าการเพิ่ม SiO2 เป็นการเสมือนเจือจางไซด์ทำงานของ TiO2 ให้พบ ้ยากขึ้นบนพื้นผิว จากรูปที่ 4.24 แสดงไอโซเทิร์มการดูดซับของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สัดส่วน SiO₂ แตกต่างกัน พบว่าเมื่อปริมาณของ SiO2 เพิ่มขึ้นการดูดซับจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพื้นที่ผิวต่อหนึ่งหน่วย มวลเพิ่มสูงขึ้น ไอโซเทิร์มการดูดซับเป็นแบบ IV กล่าวคือเป็นไอโซเทิร์มของการดูซับที่มีขนาด รูพรุน ใหญ่กว่าโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับเป็นอย่างมาก จึงเกิดการจัดเรียงตัวการดูดซับที่พื้นผิวของสารดูด

ซับเป็นสองชั้น ความชั้นของกราฟไอโซเทิร์มกล่าวได้คือ เมื่อความชันเพิ่มมากขึ้นแสดงถึงตัวถูกดูดซับ ใกล้เต็มรูพรุน และการเปลี่ยนระดับของกราฟเมื่อความดันสัมพัทธ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลอันเนื่องมาจาก การควบแน่นภายในรูพรุน การเปลี่ยนช่วงกราฟในช่วงความดันสัมพัทธ์ 0.3 คล้ายคลึงกับไอโซเทิร์ม ในรูปแบบ II แสดงถึงการดูดซับชั้นแรกอย่างสมบูรณ์ เมื่อความดันต่ำกว่า 0.3 พบเส้นไอโซเทิร์ม คายซับของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/7%SiO₂ และ TiO₂/20%SiO₂ ต่ำกว่าเส้น ไอโซเทิร์ม การดูดซับ โดยทั่วไปเส้นไอโซเทิร์มการคายซับควรมากกว่าหรือเท่ากับเส้นไอโซเทิร์มการดูดซับ แต่ ปรากฏการณ์นี้สามารถพบได้ง่ายในการดูดซับไฮโซเทิร์มแบบ IV อาจมีผลการเปลี่ยนแปลงของการ คายซับเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามมีหลายประเด็นที่มีความเป็นไปได้ อาทิเช่น การปรากฏรูพรุนขนาด เล็กบนพื้นผิว หรือแม้แต่การกำจัดสิ่งเจือปนออกไม่หมดในขั้นต่อการไล่ก๊าซก่อนทำการทดสอบการ ดูดซับทำให้เมื่อทดสอบการคายซับของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจึงพบเส้นไอโซเทิร์มการคายซับต่ำกว่า เส้นไอโซเทิร์มการดูดซับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือโมเลกุลของสิ่งเจือปนเกิดการคายซับร่วมด้วย

4.3.3 ผลกระทบของ SiO₂ ต่อแถบช่องว่างพลังงานตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ การวิเคราะห์แถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงถูกวัดวิเคราะห์ด้วย

้เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Ultraviolet-visible spectroscopy) เพื่อหาความยาวคลื่นแสงของการ ้ดูดกลืนแสง หลังจากนั้นนำค่าความยาวคลื่นแสงที่ได้ไปคำนวณด้วยวิธี Tauc's plot จากรูปที่ 4.25 ้แสดงค่าความยาวคลื่นของก<mark>ารด</mark>ูดกลื่นแสงของตั<mark>วเร</mark>่งปฏิกิริยาด้วยแสง ได้แก่ SiO₂ TiO₂ TiO₂/1%SiO₂ TiO₂/3%SiO₂ TiO₂/5%SiO₂ TiO₂/7%SiO₂ TiO₂/10%SiO₂ และ TiO₂/20%SiO₂ มีค่าเท่ากับ 219 468 414 <mark>41</mark>1 41<mark>4 413 408 และ 404 น</mark>าโนเ<mark>มต</mark>ร ตามลำดับ จากรูปที่ 4.2 คำนวณ ้ค่าแถบช่องว่างพลังงาน<mark>ของ</mark>ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมีค่าเท่ากับ 5.670 3.000 3.010 3.030 3.010 3.015 3.054 และ 3.082 eV ซึ่งอยู่ในช่วงของแถบช่องว่างพลังงานโครงสร้างเฟสผลึกแบบรูไทล์ ้สำหรับ TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ ให้ผลสอดคล้องกับเฟสโครงสร้างผลึกที่ได้วิเคราะห์จาก XRD ก่อน หน้าที่ปรากฏเฟสโครงสร้างของ TiO₂ เป็นโครงสร้างแบบรูไทล์เป็นหลัก จะเห็นได้ว่า TiO₂ เพียงอย่าง เดียวพบผลกระทบของการกลับมารวมตัวกันใหม่ของอิเล็กตรอนและโฮลที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแสง เนื่องจากแถบช่องว่างพลังงานแคบกว่าแถบช่องว่างที่ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเติม SiO2 นอกจากนั้น การเติม SiO2 ร่วมกับ TiO2 ส่งผลให้แถบช่องว่างของพลังงานเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ค่าแถบ ช่องว่างและส่วนต่อประสานระหว่างเฟสออกไซด์ไม่ว่าจะเป็นเมทริกซ์ SiO₂ หรือผลกระทบของ SiO₂ บนพื้นผิวนำไปสู่การก่อตัวของพันธะ Ti-O-Si มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะตอม Ti อย่างมาก (Panayotov, 2003) ค่าแถบช่องว่างพลังงานของ TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ รายงานโดย Balachandran (2014) มีค่าเท่ากับ 3.3 และ 3.54 eV ตามลำดับ Bellardita (2010) รายงานค่าแถบช่องว่างตัวเร่ง ปฏิกิริยา TiO₂ TiO₂-Cabot SiO₂ และ TiO₂/Axim SiO₂ มีค่าเท่ากับ 3.00 3.02 และ 2.98 eV ตามลำดับ แถบช่องว่างที่กว้างขึ้นของ TiO2/SiO2 บ่งชี้ว่าอิเล็กตรอนและโฮลจะลดการกลับมารวมตัว (Kibombo, 2012) และความสามารถในการออกซิเดชันซึ่งกลไกเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มกิจกรรม ้โฟโตคะตะไลซิสของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO2/SiO2 ภายใต้การเหนี่ยวนำแสง นอกจากนั้น โครงสร้างแบบอนาเทสและรูไทล์จะสัมพันธ์กับค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.2 eV และ 3.0 eV ตามลำดับ โครงสร้างเฟสผลึกผสมระหว่างอนาเทสและรูไทล์จะให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูง กว่าโครงสร้างเฟสผลึกแบบอนาเทสหรือรูไทล์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากอิเล็กตรอนและโฮลที่เกิด ระหว่างกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจะถูกส่งผ่านจากโครงสร้างรูไทล์ไปยังโครงสร้างอนาเทส เนื่องจากแถบการนำของโครงสร้างอนาเทสอยู่ในตำแหน่งที่มีพลังงานสูงกว่าแถบการนำของ โครงสร้างรูไทล์ประมาณ 0.2 eV ดังนั้นจึงสามารถลดอัตราการรวมตัวกันใหม่ของคู่อิเล็กตรอนและ โฮลจากการสร้างประจุโดยพลังงานแสง



รูปที่ 4.23 การวิเคราะห์ทางพื้นผิวโดยวิธี BET surface area ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแต่ละชนิด (a) พื้นที่ผิวจำเพาะ (b) ปริมาตรรูพรุน และ (c) ขนาดรูพรุน



รูปที่ 4.24 ไอโซเทิร์มการดูดซับและการคายซับของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแต่ละชนิด



รูปที่ 4.25 ค่าการดูดกล<mark>ื่นแส</mark>งของตัวเร่งปฏิกิริยา<mark>ด้วย</mark>แสงที่ปริมาณ SiO₂ แตกต่างกัน



รูปที่ 4.26 ค่าพลังงานแถบช่องว่างของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ปริมาณ SiO₂ แตกต่างกัน

จากรูป 4.27 แถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/SiO₂ ถูกยืนยันการมีเฟสผสมระหว่างรูไทล์และอนาเทสจากเทคนิค XRD (รูปที่ 4.21) แถบช่องว่างพลังงาน ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงอยู่ในช่วงระหว่าง 3.000-3.082 eV ซึ่งอยู่ในเฟสรูไทล์เป็นหลัก สำหรับ โครงสร้างเฟสรูไทล์ (CB=-0.24 eV, VB=+2.76 eV) มีค่าแถบช่องว่างพลังงานต่ำกว่าเฟสอนาเทส (CB=-0.40 eV, VB=+2.80 eV) (Haodong, 2020; Deanna, 2003; Xiaona, 2019) ซึ่งการทำงาน ร่วมกันระหว่างเฟสรูไทล์และอนาเทสจะมีแถบช่องว่างของอนาเทสที่เลื่อนออกไปมากกว่ารูไทล์ ซึ่งความต่างของช่องว่างพลังงานนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนอย่างมี ประสิทธิภาพและรวดเร็วระหว่างเฟสรูไทล์และอนาเทส อีกทั้งยับยั้งการรวมตัวกันของอิเล็กตรอน และโฮล นอกจากนี้เฟสรูไทล์มีความสำคัญม<mark>าก</mark>ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสของตัวเร่งปฏิกิริยา ้ด้วยแสงชนิด TiO₂/SiO₂ (Deanna, 2003) น<mark>ำไป</mark>สู่การถ่ายโอนอิเล็กตรอนอย่างรวดเร็วจากเฟสรูไทล์ ้ไปยังส่วนต่อประสานพลังงานที่ต่ำกว่าไปสู่<mark>ไซต์กา</mark>รทำงานของเฟสอนาเทส หลังจากนั้นถ่ายโอนจาก เฟสอนาเทสไปสู่พื้นผิวภายใต้การเหนี่ยวน<mark>ำด้</mark>วยแสง ทำให้เกิดการแยกอิเล็กตรอนและโฮลเสถียรมาก ี้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้เฟสรูไทล์ยังสามารถสร้า<mark>ง</mark>แถบกา<mark>ร</mark>นำไฟฟ้าหรือแถบคอนดักชันแบนด์ซึ่งปลดปล่อย อิเล็กตรอน (e^-) และแถบวาเลนส์แบ<mark>นด์</mark>ปลดปล่อย<mark>โฮ</mark>ล (h^+) ดังแสดงในสมการที่ 4.1 อิเล็กตรอนที่ ้ถูกเหนี่ยวนำจากเฟสรูไทล์ถูกถ่าย<mark>โอนไปยังแถบช่องว่างพล</mark>ังงานที่เคลื่อนออกไป (the off-shifted conduction band) ซึ่งเป็นช่วง<mark>แถบ</mark>พลังงานที่ประสานระหว่างเฟสรูไทล์และอนาเทส (CB=-0.27 eV, VB=+2.77) (Haodong, 2021) โฮลที่ถูกปลดปล่อยบนพื้นผิวจะถูกดักจับไว้โดยหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) และหมู่ -OH ทำหน้าที่ดึงดูดโมเล<mark>กุลของน้ำและออกซิ</mark>เจน ดังสมการที่ 4.2-4.3 (Enzo, 2016) โดยทั่วไปอิเล็กตรอนและโฮลสามารถกลับมารวมตัวกันใหม่ถ้าปราศจากสื่อกลางในการถ่าย โอนหรือเฟสผลึกที่มีเฟ<mark>สเดียว แต่ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด T</mark>iO₂/SiO₂ สามารถอำนวยความ ้สะดวกในการถ่ายโอนตัวพ<mark>าประจุไฟฟ้าที่สร้างด้วยแสงได้อย่างมีป</mark>ระสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเฟสแบบ ผสมระหว่างรูไทล์และอนาเท<mark>สกับอิเล็กตรอนที่อยู่บนผิว ดัง</mark>แสดงในสมการที่ 4.4-4.6 สามารถทำ ปฏิกิริยากับสารโมเลกุลอื่น อาทิเช่น น้ำและออกซิเจนเพื่อสร้างซูเปอร์ออกไซด์เรดิคอลและไฮดรอก ซิลเรดิคอล ดังสมการ 4.7-4.10 (Jenny, 2014) ถึงแม้ว่าการเติม SiO₂ จะไม่ได้ช่วยในกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิสทางเคมีแต่มีผลต่อกระบวนการทางโฟโตคะตะไลซิสทางกายภาพ กล่าวคือ SiO2 ้ช่วยในการก่อโครงสร้างเฟสผสมระหว่างรูไทล์และอนาเทส เพิ่มพื้นที่ผิวที่มีหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้นผิว ้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO2/SiO2 อีกทั้งช่วยเพิ่มการดูดซับโมเลกุลของออกซิเจนและน้ำให้อยู่ใกล้ ์โฟโตแอกทีฟของ TiO2 ส่งผลให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลของน้ำและออกซิเจนไปเป็นสาร ผลิตภัณฑ์มากขึ้นภายใต้การเหนี่ยวนำด้วยแสง ดังนั้นการเติม SiO2 ลงไปในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO2/SiO2 ช่วยเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพของกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับ ้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂ หรือตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีเฟสรูไทล์หรืออนาเทสเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง

$$\text{TiO}_2/\text{SiO}_2 + \text{hv} \longrightarrow \text{TiO}_2(e_{\text{Ti}} - h_{\text{Ti}}^+)$$
(4.1)

$$\text{Ti}(O-H)^{-}_{(\text{surface})} + h^{+}_{\text{Ti}} \longrightarrow \text{Ti}(O-H) \bullet_{(\text{surface})} (\text{surfacetrapping})$$
(4.2)

$$h_{Ti}^{+} + O^{2^{-}} \longrightarrow O^{-} (surfacetrapping)$$

$$(4.3)$$

$$Ti_{(surface)}^{(r)} + e_{Ti} \rightarrow Ti_{(surface)}^{(r)}$$
 (surfacetrapping) (4.4)

$$e_{Ti}^{-}(rutile) \rightarrow e_{Ti}^{-}(anatase) (electron transfer)$$
 (4.5)

$$O_2 + e^{-} \rightarrow \bullet O_2^{-}$$

$$H O_2 + h^{+} \rightarrow \bullet HO_2 + H^{+}$$

$$(4.6)$$

$$(4.7)$$

$$\bullet O_2^- + e^- + 2H^+ \longrightarrow H_2O_2$$
(4.8)

$$Ti_{(surface)}^{3+} + H_2O_2 \longrightarrow Ti_{(surface)}^{4+} + OH^- + \bullet HO$$
(4.9)

$$H_2O_2 + \bullet O_2 \longrightarrow OH^- + \bullet HO + O_2$$
(4.10)



รูปที่ 27 แนวความคิดของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/SiO2 โครงสร้างเฟสผสมระหว่างรูไทล์และอนาเทสใน กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

4.3.4 ผลกระทบของ SiO2 ต่อหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO2/SiO2

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) เพื่อ ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ดังแสดงในรูปที่ 4.28 แสดงสเปกตรัมของ FTIR ในช่วงความยาวคลื่น 700 ถึง 4000 cm⁻¹ พบการสั่นสะเทือนที่ตำแหน่ง 800 และ 1060 cm⁻¹ ซึ่งเป็นตำแหน่งของพันธะ Si–O–Si (siloxane) อีกทั้งพบการสั่นสะเทือนที่ตำแหน่ง 1630 และ 3400 cm⁻¹ ตรงกับตำแหน่งของหมู่ –OH การตรวจสอบพันธะ Si–OH (silanol) พบการสั่นสะเทือน ที่ตำแหน่ง 960 cm⁻¹ พบเฉพาะในโครงสร้างอสัณฐานที่มีองค์ประกอบของ SiO₂ และการสั่นสะเทือน ที่ตำแหน่ง 740 cm⁻¹ พบพันธะ Ti–O–Ti ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂ และ SiO₂ ในส่วนของ การเพิ่ม SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงช่วยเพิ่มหมู่ –OH บนพื้นผิว ทำให้พื้นผิวมีความเป็นกรดมาก ยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีความสามารถในการดึงดูดโมเลกุลของน้ำได้ดีและอัตราการสลายตัวของโมเลกุลของ สารเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณที่มากขึ้นของหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่บนผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ บ่งบอกประสิทธิภาพกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ TiO₂ (Kibombo, 2012) อีกทั้งความเป็นกรดเพิ่มการดูดซับบนพื้นผิวโดยที่หมู่ไฮดรอกซิลทำหน้าที่เป็นตัวดักจับโฮลและเกิด การออกซิไดซ์โมเลกุลของ H₂O ที่ถูกดูดขับบนพื้นผิวช่วยเพิ่มการแยกประจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 4.28 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงด้วยเทคนิค FTIR

4.3.5 ผลกระทบของ SiO₂ ต่อลักษณะพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ ที่ถูกเคลือบลงบนพื้นผิววัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา

้จากรูปที่ 4.29-30 แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคที่วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy; SEM) แสดงลักษณะทางสัณฐาน ้วิทยาของผลึก TiO₂ ค่อนข้างเรียบไม่ปรากฏรูพรุนบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา หากพิจารณาที่ขนาดผลึก ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ได้แก่ TiO2 (ปราศจาก SiO2) มีค่าเท่ากับ 17.1037 นาโนเมตร และ ้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/1%SiO₂ ที่ช่วงขนาดอนุภาคแตกต่างกัน ได้แก่ น้อยกว่า 38 อยู่ในช่วงขนาด ระหว่าง 45-53 53-63 63-75 และต่ำกว่า 63 ไมโครเมตร วัดขนาดผลึกมีค่าเท่ากับ 17.1037 12.6255 11.3244 9.1171 8.7713 7.1167 <mark>ตา</mark>มลำดับ ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการคำนวณขนาดผลึก จากเทคนิค XRD พบว่าเมื่อเพิ่ม SiO₂ ลงไปใ<mark>นต</mark>ัวเร่งปฏิกิริยาจะช่วยลดการก่อตัวจากโครงสร้างอนา เทสไปเป็นรูไทล์ที่มีขนาดผลึกใหญ่กว่าอนาเ<mark>ทส</mark> จะเห็นได้ว่าขนาดผลึกที่วัดได้มีขนาดที่เล็กลง ถึงแม้ว่า ขนาดอนุภาคของ SiO₂ จะอยู่ในช่วงขนา<mark>ด</mark>ที่ใหญ่ บ่งบอกถึงการรวมตัวและการปรับปรุงโครงสร้าง ทางสัณฐานวิทยาร่วมกันระหว่าง TiO2 และ SiO2 จะเห็นได้ว่าหากขนาดอนุภาคของ SiO2 อยู่ใน ้ช่วงกว้างพบว่าการกระจายขนาดผลึ<mark>กมีค</mark>วามหลา<mark>กห</mark>ลาย ดังแสดงในรูปที่ 4.29(f) หากพิจารณาที่ สัดส่วนระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ ดังแสดงตัวอย่างบางสัดส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ ้ดังแสดงในรูปที่ 4.30 ได้แก่ TiO₂ TiO₂/1%SiO₂ TiO₂/5<mark>%Si</mark>O₂ TiO₂/10%SiO₂ TiO₂/20%SiO₂ และ SiO₂ มีค่าเท่ากับ 17.1037 7.<mark>1</mark>167 4.0371 2.5162 2.7414 และต่ำกว่า 63 ไมโครเมตร ดังนั้นจึง ้ยืนยันได้ว่าการเติม SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ ช่วยลดขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยา ้ได้หากพิจารณาที่การเค<mark>ลือบ</mark>ตัวเร่งปฏิกิริยาลงบนแผ่นตะแกรงสแต</mark>นเลส 310S พบรอยแตกร้าวบน พื้นผิวจำนวนมาก เนื่อง<mark>จากข</mark>นาดผลึกของ TiO₂ กระจายตัวบนพื้น</mark>ผิววัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาได้ เป็นอย่างดี ตัวเร่งปฏิกิริย<mark>าที่ปรา</mark>ศจาก SiO₂ พบขนาดผลึกที่ใหญ่สุด เนื่องจากเกิดการรวมตัวกัน ระหว่างอนุภาคขนาดเล็กของ TiO₂ อีกทั้งผลกระทบของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ที่ถูก เคลือบบนวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา พบผลกระทบของการยึดเกาะได้ไม่ดี ดังนั้นการศึกษาในอนาคต อาจจะต้องหาสารที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างพื้นผิวของวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาและผลึกของตัวเร่ง ้ปฏิกิริยาด้วยแสงให้ยึดเกาะได้อย่างแข็งแรง เพื่อที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาบน พื้นผิวในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสสูงสุด

การเติม SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ หากพิจารณาผลกระทบที่ช่วง ขนาดอนุภาคของ SiO₂ แตกต่างกันต่อความหยาบผิวของชั้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยา โดยที่ความหยาบผิว ของแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S ที่ไม่ทำการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ 112.762 นาโนเมตร (รูปที่ 4.32(a)) การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ มีค่าเท่ากับ 206.796 นาโนเมตร (รูปที่ 4.31(a)) และ ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/1%SiO₂ ที่ช่วงขนาดอนุภาคของ SiO₂ แตกต่างกัน ได้แก่ น้อยกว่า 38 อยู่ในช่วงขนาดระหว่าง 45-53 53-63 63-75 และต่ำกว่า 63 ไมโครเมตร มีค่าเท่ากับ 433.986 322.884 225.457 211.914 126.644 และ 227.324 นาโนเมตร ตามลำดับ (รูปที่ 4.31(b)-(g)) หากพิจารณาที่ความหยาบผิวที่สัดส่วนของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ แตกต่างกัน ได้แก่ TiO₂ TiO₂/1%SiO₂ TiO₂/5%SiO₂ TiO₂/7%SiO₂ TiO₂/10%SiO₂ และ TiO₂/20%SiO₂ มีค่าเท่ากับ 206.796 227.324 275.349 296.717 294.487 และ 260.176 นาโนเมตร จะเห็นได้ว่าความหยาบ ผิวเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ SiO₂ ที่เติมลงไป แต่ที่สัดส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/20%SiO₂ พบความหยาบผิวต่ำลงมา เนื่องจากการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงลงบนแผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S (ชิ้นวัสดุตัวอย่าง) พบว่าสัดส่วนของ SiO₂ ที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อการยึดเกาะบนพื้นผิว วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาได้ไม่ดี จึงทำให้ปรากฏค่าความหยาบผิวบนแผ่นวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา มีค่าต่ำลงถึงแม้สัดส่วนของ SiO₂ จะเพิ่มขึ้นมาก็ตาม



รูปที่ 4.29 ภาพถ่าย SEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ช่วงขนาดอนุภาค SiO₂ แตกต่างกัน



รูปที่ 4.30 ภาพถ่าย SEM ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สัดส่วนของ SiO₂ แตกต่างกัน

จากรูปที่ 4.33-34 พบว่าหลังจากควบคุมช่วงขนาดอนุภาคของ SiO₂ ให้มีขนาดเล็ก ้ลงกว่าการทดลองในส่วนการทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัยหัวข้อ 4.1 ในส่วนนี้ตัวเร่งปฏิกิริยา ้ยึดเกาะและกระจายตัวได้ดีขึ้นบนวัสดุรองรับ แต่อย่างไรก็ตามส่งผลกระทบต่อเทคนิคการวิเคราะห์ ความหนาของชั้นฟิล์มในแนวระนาบสามมิติ (แกน Z) การวิเคราะห์ความหนาของชั้นฟิล์มจะอาศัย การสะท้อนกลับของแสงเมื่อตกกระทบระนาบที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาและบริเวณพื้นผิวที่ไม่มีการเคลือบ ้ตัวเร่งปฏิกิริยา แต่ด้วยคุณสมบัติของ SiO2 ที่กระจายตัวเป็นอย่างดีบนพื้นผิวที่ไม่ตอบสนองต่อการ ้สะท้อนกลับของแสงจึงไม่ปรากฏความแตกต่างของพื้นผิวทั้งสองอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นการแบ่งบริเวณของพื้นผิวทั้งสองอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 4.35



รูปที่ 4.31 ลักษณะความหยาบของพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วงขนาด อนุภาค SiO₂ แตกต่างกัน



รูปที่ 4.32 ลักษณะความหยาบของพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สัดส่วนของ SiO₂ แตกต่างกัน



รูปที่ 4.33 ลักษณะความหนาของชั้นฟิล์มหลังเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ช่วงขนาดอนุภาค SiO₂ แตกต่างกัน



รูปที่ 4.34 ลักษณะความหนาของชั้นฟิล์มหลังเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สัดส่วนของ SiO₂ แตกต่างกัน



รูปที่ 4.35 ความแตกต่างระหว่างบร<mark>ิเวณ</mark>พื้นผิวที่เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและพื้นผิวชิ้นงาน ตัวอย่างของแผ่นสแต<mark>นเล</mark>ส 3105

4.3.6 ผลกระทบของ SiO₂ ต่ออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂

รูปที่ 4.36 แสดงสเปกตรัม EPR เป็นเทคนิคการวิเคราะห์การตอบสนองของ อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยแสดงความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนของ อิเล็กตรอนจากการเหนี่ยวนำ (อนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง) สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ได้แก่ SiO₂ TiO₂ TiO₂/1%SiO₂ TiO₂/3%SiO₂ TiO₂/5%SiO₂ TiO₂/7%SiO₂ TiO₂/10%SiO₂ และ TiO₂/20%SiO₂ ตำแหน่งของค่า g ของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 2.004 (Hoadong, 2020) จากรูปสังเกตการเปลี่ยน แปลงยอดปฐมภูมิของตัวเร่งปฏิกิริยา ในทำนองเดียวกันในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส เมื่อตัวเร่ง ปฏิกิริยาได้รับการฉายรังสีจากแหล่งกำเนิดแสงเป็นตัวกระตุ้นให้แถบช่องว่างพลังงานปลดปล่อย อิเล็กตรอนและโฮลที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแสงมาอยู่บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาก่อตัวเป็นสายพารา แมกเนติก Ti³⁺ (Ti⁴⁺ + e⁻ → Ti³⁺, อิเล็กตรอนที่ติดอยู่บนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา) ดังที่เคยกล่าวใน สมการที่ 4.4 และ O⁻⁻ (O²⁻ + h⁺ → O⁻⁻, โฮลที่ติดอยู่บนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา) ก่อให้เกิดการ แยกกันระหว่างอิเล็กตรอนและโฮลอย่างเสถียรบนพื้นผิว (Enzo, 2016) ซึ่งสามารถวัดปรากฏการณ์นี้ ด้วยเทคนิค EPR ได้ในกรณีไม่มีปฏิกิริยา สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ มีความสามารถ ในการดักจับอิเล็กตรอนและโฮลไว้บนพื้นผิวด้วยพันธะ Ti–O–Si เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เกิดปฏิกิริยาบนพื้นผิวระหว่างอิเล็กตรอนและโฮลกับโมเลกุลของน้ำและออกซิเจน จากตัวเร่ง ปฏิกิริยาทั้งหมดพบว่า TiO₂/7%SiO₂ ตอบสนองต่ออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวได้ดีที่สุดหรือหาก เปรียบเทียบที่ชนิดตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ตอบสนองต่ออิเล็กตรอนคู่โดด เดี่ยวได้กว่ากว่าตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ และ SiO₂ ตามลำดับ เนื่องจากมีความเป็นเฟสผลึกผสมของ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทั้งโครงสร้างเฟสแบบรูไทล์และอนาเทสในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/SiO₂



รูปที่ 4.36 สเปกตรัม EPR แสดงการตอบสนองต่ออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (a) การตอบสนองต่อแมกเนติก (b) ค่า g-factor

4.4 ผลการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ในห้องจำลองและการทดสอบ การฆ่าเชื้อ E. coli และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอาหาร

จากสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสที่ดีที่สุดในหัวข้อ 4.2 สำหรับ สังเคราะห์ก๊าซ H2O2 จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยสภาวะการทำงานที่ดีที่สุดคือ ความเร็วของ อากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 12.0 เมตรต่อวินาที ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ในช่วง 60-65% RH ช่วงขนาดอนุภาคของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ น้อยกว่า 63 ไมโครเมตร ้สัดส่วนระหว่าง TiO₂ และ SiO₂ เท่ากับ TiO₂/1%SiO₂ สามารถสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ที่ความเข้มข้น ้สูงสุด 1.82 ppm∨ กับพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิด TiO₂/1%SiO₂ ถูกเคลือบลงบนพื้นผิว ้ วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีพื้นที่เท่ากับ 0<mark>.0</mark>117 m² (1 ด้าน) หรือคิดเป็นสัดส่วนระหว่างความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ต่อพื้นที่<mark>ผิว</mark>ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกเคลือบบนวัสดุรองรับมีค่าเท่ากับ 155.662 ppmv/m²_{cat.} เป็นระดับความเข<mark>้มข้นของ</mark>ก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้โดยปราศจากการติดตั้ง ชุดกรองอากาศทางเข้าและทางออกเครื่อง<mark>ป</mark>ฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส ในหัวข้อ 4.4 นี้ได้ทำการปรับปรุง ้เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสเพื่อเพิ่ม<mark>ป</mark>ระสิทธิ<mark>ภ</mark>าพในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ให้มีระดับความ ้เข้มข้นสูงขึ้น โดยได้ตั้งสมมติฐานว่าห<mark>ากพื้นผิวตัวเร่งป</mark>ฏิกิริยาในระบบเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาตรของ ้เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสเท<mark>่าเด</mark>ิม จะสามารถเพิ่มคว_ามเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ ้ดังนั้นจึงได้ทดสอบการติดตั้งเครื่<mark>องป</mark>ฏิกรณ์โฟโตคะตะไล<mark>ซิสแ</mark>บบอนุกรมร่วมกับติดตั้งและไม่ติดตั้งชุด กรองอากาศทางเข้าและกรองความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศทางออกเครื่องปฏิกรณ์ อีกทั้งทดสอบการ ี้ฆ่าเชื้อ *E. coli* ด้วยก๊าซ H₂O2 ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษามีดังต่อไปนี้

จากรูปที่ 4.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซ H_2O_2 ที่สังเคราะห์ได้เทียบ กับเวลาได้ทำการทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H_2O_2 โดยติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส แบบอนุกรม 1 หน่วยการเกิดปฏิกิริยาที่สภาวะการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและการเคลือบลงบนวัสดุ รองรับในสภาวะเดียวกันทั้ง 3 แผ่น ทำการทดสอบจำนวน 3 ครั้งที่วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคนละ แผ่นโดยชุดเครื่องปฏิกรณ์ปราศจากการติดตั้งชุดกรองอากาศ การศึกษาในส่วนนี้จะพิจารณาว่าหาก ต่อวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบอนุกรม 1 2 และ 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา ทุก ๆ แผ่นสามารถ สังเคราะห์ก๊าซ H_2O_2 ได้ จากการทดสอบวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา (แผ่นตะแกรงสแตนเลส 310S) แผ่นที่ 1 2 และ 3 ได้ระดับความเข้มข้นของก๊าซ H_2O_2 เฉลี่ยเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเท่ากับ 1.43 1.82 และ 1.51 ppmv ตามลำดับ หากพิจารณาที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีค่าเท่ากับ 0.21 ถือว่าอยู่ ในช่วงที่ยอมรับได้ เมื่อทราบว่าแผ่นวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสามารถดำเนินปฏิกิริยาได้ทุก แผ่นใกล้เคียงกัน ดังนั้นจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสแบบอนุกรม 1 2 และ 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยาในลำดับถึงไป

จากรูปที่ 4.38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้เทียบ กับเวลาโดยพิจารณาที่การต่อเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสแบบอนุกรม 12 และ 3 หน่วยการ เกิดปฏิกิริยาโดยชุดเครื่องปฏิกรณ์ปราศจากการติดตั้งชุดกรองอากาศ ผลการศึกษาพบว่าการต่อ ้เครื่องปฏิกรณ์แบบอนุกรมที่จำนวนหน่วยการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มในการสังเคราะห์ ้ก๊าซ H₂O₂ หรือการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ได้น้อยลง เนื่องจากผลกระทบของเครื่อง ปฏิกรณ์ทางเข้าและทางออกถูกเปิดสู่สิ่งแวดล้อม การป้อนอากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์ด้วยความเร็ว ของอากาศ 12.0 เมตรต่อวินาที เพื่อให้อากาศผ่านวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาแผ่นที่ 1 ไป 2 และ 3 ตามลำดับ พบว่าเมื่อการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์แบบระบบเปิด อากาศที่ไม่สามารถรอดผ่านแผ่น ตะแกรงสแตนเลสได้หลังจากตกกระทบแผ่นวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้อากาศและสาร ้ผลิตภัณฑ์ใหลย้อนกลับออกทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์ การตรวจสอบนี้วัดได้จากความเร็วของอากาศที่ ้ผ่านวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาแผ่นที่ 1 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 2.5 1.8 และ 1.5 เมตรต่อวินาที ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระ<mark>ทบ</mark>ของความเร็วในอากาศในหัวข้อ 4.1.2.3 และ 4.2.2 ้ที่ตกกระทบบนพื้นผิววัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิ<mark>ริย</mark>า พบว่าหากมีความเร็วของอากาศที่ต่ำเกินไปทำให้ ้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ <mark>มีแนวโน้</mark>มลดลง แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาที่ความเร็ว ้ของอากาศที่ผ่านวัสดุรองรองตัวเร่งปฏิกิริยาแผ่นสุดท้ายมีความเร็วต่ำ ๆ จะมีความเหมาะสมในการ ใช้ทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli ในการทดล<mark>อง</mark>ในลำดั<mark>บ</mark>ถัดไป เนื่องจากจะลดผลกระทบที่จะทำให้อาหาร ้เลี้ยงเชื้อแห้งในขณะที่ทำการทดสอบก<mark>ารฆ่</mark>าเชื้อ *E. <mark>coli</mark> ด้วยก๊าซ* H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ที่เวลาแตกต่าง ้กัน โดยค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1.82 1.07 และ 0.99 ตามลำดับ แนวโ<mark>น้ม</mark>ที่ลดลงนี้นอกจากจ<mark>ะมา</mark>จากผลกระทบของความเร็วของอากาศที่ ตกกระทบบนพื้นผิวของวัสดุร<mark>อง</mark>รับตัวเร่งปฏิกิริยายังมีปัจจัยอิ่น ๆ ได้แก่ การสลายตัวของก๊าซ H₂O₂ ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงและคว[ิ]ามเ<mark>สถียรทางด้านโครงสร้าง</mark>เคมีข<mark>อง</mark>ก๊าซ H₂O₂ ดังนั้นกว่าที่โมเลกุลของ ้ก๊าซ H₂O₂ จะถูกขับออก<mark>จาก</mark>เครื่<mark>องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส</mark>เนื่อ<mark>งจา</mark>กความเร็วของอากาศในการไหล ต่ำ ทำให้ได้รับผลกระทบ<mark>ดังกล่</mark>าวจึงปรากฏค่าความเข้มข้นที่ต่ำ<mark>ลง</mark>



รูปที่ 4.37 การทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ที่สภาวะเดียวกันจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แผ่น โดย ปราศจากการติดตั้งชุดกรองอากาศร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส



รูปที่ 4.38 การทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ที่สภาวะเดียวกัน โดยปราศจากการติดตั้งชุดกรอง อากาศร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส<mark>ที่ก</mark>ารต่อเครื่องปฏิกรณ์แบบอนุกรมแตกต่าง กัน

จากรูปที่ 4.39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้เทียบ ้กับเวลา โดยพิจารณาที่<mark>การต่</mark>อเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสแบบอ</mark>นุกรม 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา เพื่อลดความเร็วของอาก<mark>าศที่จะ</mark>ถูกป้อนเข้าห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli เป็นการป้องกันอาหาร เลี้ยงเชื้อแห้งก่อนทำการทดส<mark>อบที่เวลาเลี้ยงเชื้อแตกต่างกัน โด</mark>ยชุดเครื่องปฏิกรณ์ทำการเปรียบเทียบ ระหว่างการติดตั้งชุดกรองอากาศและการไม่ติดตั้งชุดกรองอากาศร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์ ทำการวัด ระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้เปรียบเทียบการวัดที่ 2 ตำแหน่งเทียบกันโดย ตำแหน่งแรกวัดภายในเครื่องปฏิกรณ์ (บริเวณหลังแผ่นวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาแผ่นสุดท้าย) ตำแหน่งที่สองวัดที่ห้องจำลองการกระจายตัวของก๊าซ H2O2 หรือห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli ้ผลการศึกษาปรากฏว่าระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เมื่อติดตั้ง ้เครื่องปฏิกรณ์ร่วมกับชุดกรองอากาศทางเข้าและออกเครื่องปฏิกรณ์ การติดตั้งชุดกรองอากาศ ้ทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์ช่วยให้อากาศที่ป้อนเข้ามาในเครื่องปฏิกรณ์ไม่ไหลย้อนกลับออกไปหรือกล่าว อีกนัยหนึ่งคือจะไม่สูญเสียความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ออกไปกับอากาศ ก่อให้เกิดการ ์ไหลเวียนแบบปั่นป่วนภายในเครื่องปฏิกรณ์ทำให้มีความสามารถในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากแผ่นรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาแผ่นที่ 2 และ 3 ภายใต้ชุดเครื่องปฏิกรณ์เดียวกัน เมื่อพิจารณาที่ระดับ ความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จากเครื่องปฏิกรณ์ที่ถูกกระจายในห้องขนาด 0.027 m³ พบว่าระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากอยู่ในระบบปิดจึงเกิด

การสะสมตัวและการสลายตัวของก๊าซ H₂O₂ ค่อนข้างคงที่ภายในห้องทดสอบ จึงปรากฏค่าความ เข้มข้นใกล้เคียงกับตำแหน่งที่วัดภายในเครื่องปฏิกรณ์ นอกจากนั้นการติดตั้งชุดกรองอากาศทางออก เครื่องปฏิกรณ์หรือทางเข้าห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ เป็นการป้องกันสิ่งเจือปนและความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศที่หลงเหลือจากการทำปฏิกิริยาภายในเครื่องปฏิกรณ์เข้าไปในห้องทดสอบซึ่งอาจจะเป็นปัจจัย หรือผลกระทบสำคัญที่มีผลต่อการศึกษาการฆ่าเชื้อ *E. coli* ในลำดับถัดไป



รูปที่ 4.39 เปรียบเทียบเ<mark>ครื่อง</mark>ปฏิกรณ์แบบอนุกรม 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยาที่มีแผ่นกรองและไม่มี แผ่นกรองอากาศร่วมกับชุดเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส

จากรูปที่ 4.40 แสดงการเปลี่ยนแปลงของแผ่นวัดก๊าซ H_2O_2 เพื่อยืนยันการมีอยู่ของก๊าซ H_2O_2 ที่สังเคราะห์ได้ที่กระจายตัวในห้องทดสอบ โดยใช้หลักการอย่างง่ายคือหากพบว่ามีก๊าซ H_2O_2 สีของแผ่นวัดก๊าซ H_2O_2 จะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียว การเปลี่ยนแปลงสีนี้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับค่าความเข้มข้นของก๊าซ H_2O_2 ในระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในระบบปลอดเชื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ในการยืนยันการมีอยู่ของก๊าซ H_2O_2 เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีของก๊าซ H_2O_2 เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะยืนยันได้ว่ามีก๊าซนั้นอยู่ในระบบจริงหรือไม่ ในงานวิจัยนี้ยืนยันการมีอยู่ของก๊าซ H_2O_2 ที่สังเคราะห์ได้โดยวัดจากอุปกรณ์วัดความเข้มข้นของก๊าซ H_2O_2 และแผ่นวัดก๊าซ H_2O_2 จากการทดสอบการวางแผ่นวัดก๊าซ H_2O_2 ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในห้อง ทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ H_2O_2 พบว่าเกิดการเปลี่ยนสีของแผ่นวัดก๊าซ H_2O_2 ค่อนข้าง สม่ำเสมอกันถึงแม้จะวางที่ตำแหน่งแตกต่างกัน ซึ่งช่วยยืนยันได้ว่าก๊าซ H_2O_2 ที่สังเคราะห์ได้กระจาย ตัวได้ดีในห้องทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ H_2O_2



รูปที่ 4.40 การตรวจสอบการกระจายตัวและการมีอยู่ของก๊าซ H₂O₂ ในห้องทดสอบการฆ่าเชื้อด้วย แผ่นวัดก๊าซ H₂O₂ ที่ตำแหน่งแตกต่างกัน

การทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli ด้วยก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จากเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะ ตะไลซิสแบบต่ออนุกรม 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยา จากรูปที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli ด้วยเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสแบบปราศจากการติดตั้งชุดกรองอากาศ พบว่าระดับความ เข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้อยู่ในระดับตามที่ได้อธิบายผลกระทบของการติดตั้งเครื่อง ปฏิกรณ์รูปแบบนี้ในรูปที่ 4.38 เมื่อศึกษาค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อ E. coli ที่เวลาแตกต่างกันที่ 1 ถึง 6 ชั่วโมง พบว่าการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli ที่อยู่ในห้องทดสอบการยับยั้งเชื้อ เจริญเติบโต ได้ดีกว่าสภาวะภายในห้องปกติ เนื่องจากไม่มีแผ่นกรองอากาศร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์ที่ต่อเข้ากับห้อง ทดสอบการฆ่าเชื้อ อีกทั้งความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ยังหลงเหลือจากการทำปฏิกิริยาถูกป้อนเข้า ไปในห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ยังหลงเหลือจากการทำปฏิกิริยาถูกป้อนเข้า ไปในห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ยังหลงเหลือจากการทำปฏิกิริยาถูกป้อนเข้า ไปในห้องกดสอบการฆ่าเชื้อ ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ยังหลงเหลือจากการทำปฏิกิริยาถูกป้อนเข้า เข้าคัญของการเจริญเติบโตของเชื้อ อีกทั้งอุณหภูมิภายในห้องทดสอบสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกห้อง ทดสอบ เนื่องจากได้รับผลกระทบทางด้านความร้อนจากแหล่งกำเนิดแสง (หลอด UVC) และความ ร้อนจากมอเตอร์ของโบลเวอร์หลังจากดำเนินปฏิกิริยาเป็นเวลานานขึ้น ดังนั้นด้วยปัจจัยเหล่านี้จึง ส่งผลให้ค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องทดสอบการฆ่าเชื้อสูงกว่าค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยง เชื้อที่ไม่ได้ทดสอบการยับยั้งเชื้อด้วยก๊าซ H₂O2

้จากหลายปัจจัยที่ได้กล่<mark>าวถึ</mark>งผลกระทบในส่วน<mark>การ</mark>อธิบายรูปที่ 4.42 ในส่วนการศึกษานี้ได้ ติดตั้งชุดกรองอากาศร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์โพโตคะตะไลซิส เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ้ที่สังเคราะห์ได้ และการป้องกันการปนเปื้อนในอากาศเข้าสู่ระบบ อีกทั้งป้องกันความชื้นสัมพัทธ์ใน ้อากาศที่ยังหลงเหลือจาก<mark>การ</mark>ดำเ<mark>นินปฏิกิริยาเข้าสู่ห้องทด</mark>สอบการยับยั้งเชื้อ โดยในแต่ละชั่วโมงจะสุ่ม ้หยิบจานอาหารเลี้ยงเชื้อ<mark>ตัวอย่</mark>างที่ระดับแตกต่างกัน 3 ตัวอย่<mark>าง เพื่</mark>อหาค่าเฉลี่ยสำหรับตัวอย่างที่อยู่ ในห้องทดสอบการฆ่าเชื้อด้<mark>วยก๊าซ</mark> H₂O₂ จากผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มการเจริญเติบโตของเชื้อที่ทำ การยับยั้งการเจริญเติบโตแล<mark>ะไม่ได้ทำการยับยั้งการเจร</mark>ิญเติบโตด้วยก๊าซ H₂O₂ มีค่าความขุ่นไม่ แตกต่างกันมาก เมื่อสังเกตค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการหยิบสุ่มตัวอย่างที่ระนาบแตกต่างกันในห้อง ทดสอบการฆ่าเชื้อ พบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กว้างกว่าการหยิบสุ่มตัวอย่างในระนาบเดียวกัน จากผลการศึกษาในส่วนนี้ทำให้เห็นว่าตำแหน่งการวางจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ระนาบแตกต่างกันส่งผล ต่อค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งค่าความขุ่นที่วัดได้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณ เชื้อ E. coli ที่เติบโตอาหารเลี้ยงเชื้อ (ขุ่นมากเชื้อเจริญเติบโตได้ดีและขุ่นน้อยเชื้อเจริญเติบโตน้อย) จากผลกระทบดังกล่าว ได้ทำการศึกษาผลกระทบของการวางตำแหน่งอาหารเลี้ยงเชื้อที่ระนาบ แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.43 หากพิจารณาที่ค่าเฉลี่ยปรากฏค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วงกว้าง เช่นเดียวกับผลการศึกษาในรูปที่ 4.42 ระนาบในการวางจานอาหารเลี้ยงเชื้อแบ่งออกเป็น 3 ระนาบ ้ได้แก่ N1 (ระนาบบนสุด) N2 (ระนาบกลาง) และ N3 (ระนาบล่างสุด) ในห้องทดสอบการฆ่าเชื้อจะ ้เห็นได้ว่าระนาบที่เหมาะสมในการทดสอบการฆ่าเชื้อคือ ระนาบ N2 ซึ่งเป็นระนาบที่อยู่ตรงกับปล่อง ทางออกของเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส แต่อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการทดลองหากวาง

้อาหารเลี้ยงเชื้อในระนาบเดียวที่ต่ำแหน่งล่างสุด จะส่งผลต่อการฆ่าเชื้อได้สูงสุด หากวางอาหารเลี้ยง ้เชื้อมากกว่า 2 ระนาบขึ้นไปและจำนวนจานอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละระนาบเพิ่มขึ้น พบว่าตำแหน่ง บริเวณระนาบตรงกลาง (N2) ฆ่าเชื้อได้สูงสุด เนื่องจากระนาบล่างสุดพบผลกระทบของการกระจาย ้ตัวของก๊าซ H₂O₂ จากเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสถูกกีดขวางด้วยจานอาหารเลี้ยงเชื้อในระนาบที่ N2 ทำให้การกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ลงมาในระนาบที่ N3 ได้ไม่ค่อยดี ส่วนการวางจานอาหาร ้เลี้ยงเชื้อที่ระนาบ N1 พบการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ไหลขึ้นทางด้านล่างของจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ทำให้การฆ่าเชื้อเกิดขึ้นได้ไม่ดี หากพิจารณาการฆ่าเชื้อ *E. coli* ที่ระนาบ N2 กับค่าความข่นของ ้อาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ทำการฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂ ดังแสดงในรูปที่ 4.44 พบการฆ่าเชื้อ *E. coli* ได้ดี ้สุดในห้องทดสอบการฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂ ห<mark>าก</mark>พิจารณาที่ค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ทำ การฆ่าด้วยก๊าซ H₂O₂ แต่ถูกวางไว้ในสภาว<mark>ะป</mark>กติในห้องทดลองเดียวกัน พบค่าความขุ่นสูงกว่า ้เล็กน้อยอาจจะเนื่องจากอุณหภูมิภายในห้<mark>องเท่ากั</mark>บ 27°C ทำให้เชื้อ *E. coli* เจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดี เมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ที่อยู่ในช่วง 30-32℃ เนื่องจากเชื้อ E. coli ที่ใช้ทดสอบ เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงในช่วง 37°C แต่หากเปรียบเทียบเฉพาะผลของอุณหภูมิในช่วง 30-32°C ระหว่างอุณภูมิจากเครื่องปฏิกรณ์ที่<mark>มีก</mark>ารฆ่าเชื้อ <mark>E.</mark> coli ด้วยก๊าซ H₂O₂และไม่มีการยับยั้งการ ้เจริญเติบโตของเชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂ <mark>พบค่าความต่างของค่า</mark>ความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างเห็นได้ ชัดเจน

การฆ่าเชื้อ E. coli ด้วยก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีหลาย ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงหากต้องการให้เกิดการฆ่าเชื้อ E. coli เกิดขึ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือค่าความ ขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อไม่เปลี่ยนแปลงหรือค่าความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อเริ่มต้นลดลงหลงทำการฆ่า เชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂ ประเด็นแรกมุ่งไปที่การเพิ่มระดับความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้โดย การปรับแต่งที่ตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีการยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาให้ได้ดียิ่งขึ้น ประเด็นที่ 2 ความหนาของอาหารเหลวที่เลี้ยงเชื้อที่ใช้ทดสอบการฆ่าเชื้อ หากทดสอบกับอาหารเลี้ยง เชื้อที่เป็นของเหลว อาจจะพบการฆ่าเชื้อได้ไม่ค่อยดี เนื่องจากก๊าซ H₂O₂ ไม่สามารถถูกกดลงไปใน อาหารเหลวโดยปราศจากแรงขับเคลื่อน ถึงแม้จะเกิดการฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวได้แต่เชื้อที่อยู่ลึกลงไป ในชั้นฟิล์มของอาหารเหลวยังคงเจริญเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ จึงทำให้ยังมีแนวโน้มของค่าความขุ่นที่ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การทดสอบการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอาหารที่มีความแห้งบนพื้นผิวพบแนวโน้มในการฆ่าเชื้อบน พื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปที่ 4.45-48 แสดงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว ของขนมปังไม่ปรากฏเชื้อราบนขนมปังที่ทำการฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂ ในส่วนของขนมปังที่ไม่ได้ทำ การฆ่าเชื้อบนพื้นผิวพบการเกิดของเชื้อราเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 หลังจากทำการทดสอบการฆ่าเชื้อ ใน ส่วนของการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแอปเปิ้ลพบแนวโน้มเดียวกัน ราบนพื้นผิวของแอปเปิ้ลปรากฏโคโลนีสีดำ ออกเขียวบนพื้นผิว ในส่วนของสีน้ำตาลเข้มบนพื้นผิวเป็นส่วนของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ น้ำตาลและก๊าซ H₂O₂ สีน้ำตาลบนพื้นผิวของแอปเปิ้ลปรากฏชัดเจนขึ้นหลังทำการทดสอบการฆ่าเชื้อ ด้วยก๊าซ H₂O₂ เป็นระยะเวลาที่นานขึ้น ในส่วนของการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของหอมแดงที่ถูกหั่นปรากฏ ลักษณพื้นผิวคล้ายคลึงกับแอปเปิ้ล แต่อย่างไรพบพบกระทบในส่วนของพื้นผิว ลักษณะพื้นผิวของหัว หอมแดงมีลักษณะเป็นกลีบก๊าซ H₂O₂ อาจจะกระจายตัวได้ไม่ทั่วถึงและพบว่าระยะเวลาในการฆ่า เชื้อบนพื้นผิวหัวหอมแดงอยู่ที่เวลา 2 ชั่วโมง ในส่วนของพื้นผิวถั่วลันเตาพบประสิทธิภาพของการฆ่า เชื้อบนพื้นผิวหลังทำการฆ่าเชื้อเป็นระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง แต่อย่างไรพบผลกระทบของพื้นผิว ผลไม้ที่ พบแผลบนพื้นผิวสูงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่ำ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแห้งมีความ เป็นไปได้ในการประยุกต์องค์ความรู้ในงานวิจัยร่วมกับการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวด้วยก๊าซ H₂O₂ จาก กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส แต่อย่างไรก็ตามพื้นผิวของอาหารแต่ละชนิดมีเชื้อชนิดแตกต่างกัน ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวจึงมีระยะเวล<mark>าที่</mark>แตกต่างกัน



รูปที่ 4.41 การทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยปราศจากชุดกรองอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ใน อากาศร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส


รูปที่ 4.42 การทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยมีชุดกรองอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับ เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิส



รูปที่ 4.43 การทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยมีชุดกรองอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับ เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสที่ระนาบการวางจานอาหารเลี้ยงเชื้อแตกต่างกัน



รูปที่ 4.44 การทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยมีชุดกรองอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับ เครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสที่สำหรับห้องทดสอบการฆ่าเชื้อ และบริเวณที่ไม่มีการฆ่า เชื้อด้วยก๊าซ H₂O₂





รูปที่ 4.45 ผลการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวขนมปัง



รูปที่ 4.46 ผลการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวหัวหอมแดง



รูปที่ 4.47 ผลการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแอปเปิ้ล



รูปที่ 4.48 ผลการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวถั่วลันเตา

4.5 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂

หัวข้อนี้ทำการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจในการต่อยอดเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ โดยการ วิเคราะห์จากข้อมูลทางการตลาด การเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้

4.5.1 การวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด

ตลาดเจลทำความสะอาดมือทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 9.93% ระหว่างปี 2019 ถึง 2028 และคาดว่าจะสร้างรายได้ 2.89 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 เจลทำความสะอาด มือเป็นสารเคมีซึ่งส่วนใหญ่ใช้แทนสบู่และน้ำเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อบนมือและป้องกันการแพร่กระจาย ของการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ปัจจัยสำคัญที่ขั<mark>บเค</mark>ลื่อนการเติบโตของตลาดเจลล้างมือทั่วโลก ได้แก่ การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมเจลล้างมือ ความต้องการเจลล้างมือ ้เพิ่มขึ้น ตัวขับเคลื่อนสำคัญที่เพิ่มการเติบโตในตลาดเจลทำความสะอาดมือทั่วโลก กำลังเพิ่มขึ้น ้อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เช่น การติดเชื้อที่ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลได้รับหลังจากรับการรักษาทา<mark>ง</mark>การแพ<mark>ท</mark>ย์บางประเภท แม้กระทั่งการดูแลสุขภาพปัจจุบัน ้เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์หลากหลาย<mark>ประ</mark>เภทแล<mark>ะใช้ข</mark>ั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษาผู้ป่วยในการช่วยให้ ้ผู้ป่วยฟื้นตัว อีกทั้งความกลัวที่เพิ่มขึ้<mark>นขอ</mark>งโรคซาร์ส<mark> อีโ</mark>บลา โคโรนาไวรัส และโรคไข้หวัดหมู H1N1 ้กำลังเพิ่มการแพร่กระจายของโรค<mark>ติด</mark>ต่อทางการสัมผัสเ<mark>ชื้อซึ่</mark>งเพิ่มความตระหนักของผู้บริโภคเกี่ยวกับ เจลล้างมือในปี 2019 ส่วนแบ่ง<mark>ราย</mark>ได้ประมาณ 42.34<mark>% ถูก</mark>จำแนกตามหมวดหมู่ที่ใช้เจลในแง่ของ เจลทำความสะอาดมือ การใช้เ<mark>จ</mark>ลทำความสะอาดมืออย่างสม่ำ<mark>เ</mark>สมอช่วยให้เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคที่ ้ดีที่สุด นอกจากนี้ความหน<mark>ืดข</mark>องผ<mark>ลิตภัณฑ์ยังช่วยให้มั่นใจได้</mark>ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกจ่ายโดยตรงและอยู่บน ี่มือทั้งสองข้างจนกว่าจะ<mark>ถูกัน ความต้องการใช้เจลทำควา</mark>มสะ<mark>อาด</mark>มือเพิ่มขึ้น 1,400% จากเดือน ้ธันวาคม 2019 ถึงมกร<mark>าคม 2</mark>020 เนื่องจาก<mark>ความกลัวการระบาดข</mark>องโคโรนาไวรัส อีกทั้งมีสารพิษ ู้ที่เป็นอันตรายที่เพิ่มขึ้นใน<mark>ผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือ ความผ</mark>ันผวนของราคาวัตถุดิบ สิ่งเหล่านี้ ้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางก<mark>ารเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์เจ</mark>ลทำความสะอาดมือทั่วโลก การใช้เจล ทำความสะอาดมืออย่างต่อเนื่องอาจลดโอกาสการติดเชื้อซึ่งเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดี ซึ่งช่วย ้ป้องกันแบคทีเรียที่เป็นอัตราย เจลทำความสะอาดมือประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด เช่น เบนซาล ้โคเนียมคลอไรด์ เอทิลแอลกอฮอล์ และยูเรียที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการ ปัจจัยเหล่านี้ ้คาดว่าจะยับยั้งการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ แนวโน้มตลาดเจลทำความสะอาดมือ ทั่วโลกในอเมริกาเหนือคาดว่าจะถือหุ้นใหญ่ที่สุดภายในปี 2571 และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะ เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาคาดการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค ความตระหนัก ้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของการถูกสุขอนามัย เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโต โดยรวมของตลาดในอเมริกาเหนือ

4.5.2 การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย

กลุ่มตลาดที่จะนำเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ ในการทำแผนธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มตลาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวแบบพกพาสำหรับฆ่าเชื้อโรค ในปัจจุบันกลุ่มตลาดนี้ออกมาใน รูปแบบเจลทำความสะอาดมือในหลากหลายรูปแบบ (1) เจลที่ใช้ถูฝามือโดยตรง (2) สเปรย์สามารถ ฉีดได้บริเวณกว้างขึ้นแต่มีข้อจำกัดในพื้นที่ที่ต้องการความแห้งและไม่สามารถพ่นบริเวณใบหน้าได้ (3) โฟมจำเป็นต้องชำระล้างด้วยน้ำ (4) ผ้าเซ็ดมีปัญญาเรื่องการใช้แล้วต้องทิ้งไม่สามารถใช้ซ้ำได้ (5) ของเหลวมีปัญหาที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อในขณะฆ่าเชื้อ แต่เทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ จะ เข้ามาเป็นทางเลือกที่ (6) ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วโดยใช้ก๊าซ H₂O₂ แบบแห้ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ก๊าซ H₂O₂ รายแรกที่จะประดิษฐ์การฆ่าเชื้อแบบพกพาโดยใช้ก๊าซ H₂O₂ โดยกลุ่มตลาดเป้าหมายจะ เป็นกลุ่มที่ต้องการฆ่าเชื้อส่วนบุคคล ได้แก่ บุลคลาการสำนักงาน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ใช้งาน ทั่วไปที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ ผู้ใช้งานที่ต้องการความสะอาดและความทันสมัยและการฆ่า เชื้อบนพื้นผิวอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์

4.5.3 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้า<mark>หม</mark>าย

การประเมินกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นการประเมินแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยออกแบบจาก การสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ราย จากการวิเคราะห์กลุ่มผู้สัมภาษณ์พบว่าโดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงถึง 70% ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นพิเศษจากเชื้อโรค เป็นกลุ่มนักศึกษา รายได้ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือน การดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ เป็น กลุ่มที่พบเจอกับผู้คนมากมายต่อวัน เที่ยวในวันหยุด การดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโคโรน่าไวรัส กลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีการดูแลตัวเองเป็นพิเศษร่วมกับการเลือกผลิตภัณฑ์ สำหรับป้องกันส่วนบุคคล อาทิเช่น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยราคาสินค้าที่ กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้ออยู่ในช่วงราคา 100 ถึง 300 บาท หากซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อหรือร้าน ขายยาทั่วไป ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์พบว่าใช้ทุกครั้งที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ ข้อดีของกลุ่มลูกค้าที่ ตัดสินในในการสั่งซื้อ ได้แก่ ง่ายต่อการใช้งาน น้ำหนักเบา แห้งเร็ว ปัญหาของกลุ่มลูกค้าที่ยังพบเจอ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในปัจจุบัน คือ ใช้หมดง่าย ผิวแห้ง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วไปหยิบ จับอาหารพบว่ามีรสขมปนเปื้อนในอาหาร ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ยังมีความต้องการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ มีกลิ่นหอม ใช้งานง่าย ไม่ก่อผลเสียต่อสุขภาพ

4.5.4 ความต้องการต่ำสุดของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มลูกค้ายอมรับได้

การประเมิน MVP (minimum viable product) คือ การสร้างฟีเจอร์น้อยที่สุดเพื่อ ทดสอบตลาด โดยการส่งมอบฟีเจอร์นั้นให้กับลูกค้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ นอกจากจะเป็นการ ป้องกันความเสี่ยงที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วไม่มีคนใช้ การประเมิน MVP ยังช่วยเร่ง การเรียนรู้ให้ธุรกิจสามารถค้นพบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีแนวโน้มประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การต่อยอด ปรับปรุง หรือแก้ไขต่อไป โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ราย โดยการตั้งคำถามที่มีผลต่อการประเมิน MVP ดังต่อไปนี้

คำถาม (1) หากมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อส่วนบุคคล *"ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกส่วนบน ร่างกายและทุกพื้นผิวโดยไม่ส่งผลเสีย"* คุณมีความคิดเห็นอย่างไร คำตอบ (1) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความสนใจ เนื่องจากสเปรย์แอลกอฮอล์ส่งผล เสียต่อร่างกาย อาทิเช่น ละอองฟุ้งเข้าตา ผิวแห้ง สารไวไฟ และแอลกอฮอล์ยังทำลายพื้นผิวพวก กระเป๋าหนัง และเครื่องประดับเป็นต้น

คำถาม (2) หากมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อส่วนบุคคล *"ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง"* คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

คำตอบ (2) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสนใจเพราะสะดวกไม่ต้องเติม บ่อยครั้ง

คำถาม (3) หากมีสินค้ารูปลักษณ์แบบนี้ อยากให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในด้าน ใดบ้าง เช่น สี ขนาด น้ำหนัก

คำตอบ (3) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอยากให้มีขนาดเล็ก พกพาง่าย และน้ำหนักเบา

คำถาม (4) คุณคิดว่าผล<mark>ิต</mark>ภัณฑ์<mark>ดั</mark>งกล่าวควรมีราคาเท่าไร

คำตอบ (4) ผู้ให้สัมภาษ<mark>ณ์</mark>ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอยากให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดย ราคาไม่เกิน 500 บาท

คำถาม (5) หากผลิ<mark>ตภัณฑ์นี้วางจำหน่</mark>าย อยากให้วางขายผ่านช่องทางไหน

คำตอบ (5) ผู้ใ<mark>ห้สัม</mark>ภาษณ์ส่วนใหญ่มีค<mark>วาม</mark>คิดเห็นว่าอยากให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าววาง

จำหน่ายที่ร้านขายยา

คำถาม (6) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควรมีการส่งเสริมการตลาดอย่างไร?

คำตอบ (6) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอยากให้มีพนักงานขายคอยให้ คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภั<mark>ณฑ์</mark>

คำถาม (7) ถ้าคุณต้องการซื้อไฮโดรพอร์ต อะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้คุณเปลี่ยน จากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบบเดิมมาใช้ไฮโดรพอร์ต

คำตอบ (7) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สนใจในประเด็นที่ใช้ได้ไม่จำกัด ครั้งมากที่สุด

4.5.5 กลยุทธ์ทางธุรกิจ

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ราย ได้ทำการประเมินแผนธุรกิจอย่าง ง่ายเพื่อออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการประเมิน 9 ด้านดังแสดงต่อไปนี้

ตารางที่ 4.3 แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 1) Value Propositions (คุณค่าของสินค้า/บริการที่นำเสนอแก่ลูกค้า) สามารถฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแห้ง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออาหาร • ก๊าซ H₂O₂ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงถึงแม้ใช้ในความเข้มข้นที่ต่ำ ก๊าซ H2O2 ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากแตกตัวเป็น O2 และ H2O ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความทันสมัยเนื่องจากได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามพกพาง่าย • ใช้ฆ่าเชื้อได้ไม่จำกัดครั้ง สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้ทุกจุดที่ต้องการฆ่าเชื้อไม่เหนียวเหนอะหนะ และแห้งหลังการฆ่าเชื้อเสร็จ ไม่มีสีและกลิ่นดังนั้นจึงสามารถฆ่าเชื้อได้ห<mark>ลาก</mark>หลายรูปแบบ 2) Key Activities (กิจกรรมหลักของโครงการ) การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ H₂O₂ ให้กลุ่ม<mark>เ</mark>ป้าหมาย เนื่องจากคำว่าสารเคมีอาจส่งผลต่อความ วิตกกังวนในการตัดสินใจในการเลือกใช้<mark>เ</mark>ทคโนโ<mark>ล</mark>ยีใหม่ การสร้างเรื่องราวของสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่ม<mark>เป</mark>้าหมายเพื่อดึงดูดให้เกิดความอยากซื้อสินค้า ประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูธและ<mark>อีเว้</mark>นท์ตามงา<mark>นแส</mark>ดงสินค้า การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แนะนำการใช้งานสินค้าผ่านโฆษณาหรือตัวแทนจำหน่าย • บริการหลังการขาย 3) Key Partners (พันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในโครงการ) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี • นักลงทุน บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ บริษัทผู้จำหน่ายและกระจายสินค้า 4) Key Resources (ทรัพยากรหลักที่ใช้ในโครงการ) เงินลงทุนในการทำเครื่องต้นแบบ การทดสอบ การปรับปรุง รวมถึงแผนทางธุรกิจและการตลาด บุคลากร (ผู้เชี่ยวชาญ/วิจัย) วิศวกรรมเคมีในการหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของตัวเครื่อง นักวิจัยและวิศวกรสำหรับการออกแบบเครื่องต้นแบบที่ใช้งานได้จริงและมีความปลอดภัยต่อ การใช้งาน • นักการตลาดและออกแบบแนวทางธุรกิจเพื่อวางแผนความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในการต่อ ยอดทางธุรกิจ สถานที่วิจัยและทดสอบการใช้งาน ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี ศูนย์เครื่องมือ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับทำวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำหรับพัฒนาเครื่องต้นแบบ

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับการวางแผนทางธุรกิจของเทคโนโลยี

ตารางที่ 4.3 แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (ต่อ)

5) Customer Segments (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
 กลุ่มบุคลากรสำนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฆ่าเชื้อส่วนบุคคล
 กลุ่มบุคคลที่ต้องการการฆ่าเชื้อส่วนบุคคลเป็นพิเศษ
 กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้องการฆ่าเชื้อส่วนบุคคล
6) Customer Relationships (กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)
● ศูนย์บริการลูกค้า (Call center) หรือ Online chat ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและข้อมูลความ
คิดเห็นของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
 การสร้างเรื่องราวของสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 การขายชิ้นส่วนของอุปกรณ์บางส่วนต่อเนื่อง จะทำให้สามารถดึงกลุ่มลูกค้าให้อยู่กับสินค้าได้นาน
ยิ่งขึ้น แผ่นตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนทุก 1 ป <mark>ี หลอดย</mark> ูวี และแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น
 ข้อมูลการใช้งานสินค้าและผลการทดสอบการฆ่าเชื้อเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในเทคโนโลยี
 การสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างลูกค้ากับลูกค้า (ลูกค้าเป็นตัวแทนจำหน่าย)
● มีการรับประกันสินค้า ภายใน 1 ปี 📙 🔔 🦌
7) Channels (ช่องทางการจัดจำ <mark>หน่า</mark> ย)
ช่องทางการเข้าถึงลูกค้ามีการทำ <mark>การ</mark> ตลาด 2 รูปแบบ ดั <mark>งนี้</mark>
 Offline Marketing โดยมีการจำหน่ายเครื่องไฮโดรพอร์ต ผ่านทางหน้าร้าน, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ
 Online Marketing โดยมีการจำหน่ายเครื่องไฮโดรพอร์ต ผ่านทาง Facebook, Instagram, Line@ และทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าตลาดใหญ่
8) Cost Structure (<mark>โครงสร้าง</mark> ต้นทุน)
 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (โฆษณา,ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ)
 ค่าใช้จ่ายด้านการผลิต
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ยากาศเป็นโลยี ยาการเป็นไลยี่ ยาการเป็นไลย์
 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
9) Revenue Streams (ประมาณการรายได้)
● ขายเครื่องเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂
 ขายอุปกรณ์ชิ้นส่วนเมื่อต้องการเปลี่ยน (แผ่นตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ หลอดยูวี แผ่นกรอ
. จุขั้น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็

บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปผลงานวิจัย

ในงานวิจัยนี้ทำการศึกษาการผลิตก๊าซ H₂O₂ จากกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสสำหรับการใช้ งานด้านการฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิว โดยงานวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนแรก ทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย ส่วนที่สองหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ส่วนที่สามศึกษาบทบาทของ SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ สำหรับกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ส่วนที่สี่ทดสอบการ กระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ในห้องจำลองและการทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* และการ ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอาหาร ส่วนสุดท้ายผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1.1 สรุปผลการทด<mark>สอบ</mark>ความเป็นไปได้ขอ<mark>งงา</mark>นวิจัย

การทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จ<mark>ากค</mark>วามชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวน การโฟโตคะตะไลซิส โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสองชนิดในการทดสอบ ได้แก่ TiO2 และ TiO₂/SiO₂ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริย<mark>าด้วยแส</mark>งชนิด TiO₂/SiO₂ มีแนวโน้มในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ้ที่ระดับความเข้มข้นสูง<mark>กว่า</mark>ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ เพียงอย่างเ<mark>ดียว</mark> จากการวิเคราะห์ลักษณะทาง กายภาพของตัวเร่งปฏิกิร<mark>ิยาสอ</mark>งชนิด พบว่าตัวเร่งปฏิกิร<mark>ิยาชนิด</mark> TiO₂/SiO₂ พบโครงสร้างรูพรุน ้จำนวนมากบนพื้นผิว ส่วนพื้น<mark>ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO</mark>2 แสดงลักษณะค่อนข้างเรียบไม่ปรากฏ โครงสร้างรูพรุนบนพื้นผิว ซึ่งโครงสร้างรูพรุนบนพื้นผิวของ TiO2/SiO2 มาจากคุณสมบัติของ SiO2 ที่ถูกสังเคราะห์มาจากแกลบพบความบริสุทธิ์ของ SiO2 ที่สังเคราะห์ได้ 99.40% คุณสมบัติความพรุน นี้คาดว่าจะเพิ่มความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด TiO₂ และ TiO₂/SiO₂ (1:0.76 %(w/w)) ปรากฏโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสเป็นหลักและ SiO₂ ที่สังเคราะห์ได้พบโครงสร้างแบบอสัณฐาน ในส่วนของการทดสอบสภาวะการทำงานของเครื่อง ปฏิกรณ์ที่ดีที่สุดในส่วนนี้ ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 60% RH และพบว่าเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศสูงกว่า 60% RH พบผลกระทบของการดูดซับภายในรูพรุนของโมเลกุลของน้ำและที่ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำกว่า 60% RH พบผลกระทบการสลายตัวของก๊าซ H₂O₂ ภายใต้ แหล่งกำเนิดแสงและการสลายตัวทางด้านโครงสร้างเคมีที่ไม่เสถียรเป็นหลัก หากพิจารณาที่ความเร็ว ของอากาศที่เหมาะสมทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์มีค่าเท่ากับ 8.2 เมตรต่อวินาที

5.1.2 สรุปผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

จากผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส พบว่าสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศเท่ากับ 60-65% RH ความเร็วของอากาศทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 12.0 เมตรต่อวินาที ขนาดอนุภาคของ SiO₂ ต่ำกว่า 63 ไมโครเมตร สัดส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/1%SiO₂ สามารถ สังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ได้ค่าความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 3 ppmv เมื่อทดสอบผลกระทบของความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ซึ่งให้แนวโน้มผลการศึกษาเช่นเดียวกันกับการใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ดังที่ได้สรุปในหัวข้อ 5.1.1 แสดงว่าที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงกว่า 65% RH ไม่ได้มีผลกระทบจากการดูดซับภายในรูพรุนเพียงอย่างเดียวสำหรับ TiO₂/SiO₂ เนื่องจากพบ ปรากฏการณ์นี้ถึงแม้จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด TiO₂ ทดสอบเพียงอย่างเดียว แสดงว่าผลกระทบหลักที่ เกิดขึ้นในส่วนนี้มากจากผลกระทบของการควบแน่นโมเลกุลของน้ำบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นหลัก ทำให้เกิดเป็นเหมือนฟิล์มของน้ำที่กั้นระหว่างแหล่งกำเนิดแสงและพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ลดลง เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำกว่า 60% RH ให้ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า

5.1.3 สรุปบทบาท S<mark>iO</mark>2 ในตัวเร่งปฏิกิริยา<mark>ด้ว</mark>ยแสง TiO2/SiO2 สำหรับกระบวนการ โฟโตคะตะไลซิส

การเติม SiO₂ ในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ช่วยเพิ่มบทบาททางกายภาพของ กระบวนการโพโตคะตะไลซิสเป็นหลัก พบว่าการเติม SiO₂ ช่วยสร้างเฟสผสมระหว่างรูไทล์และอนา เทสของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ ซึ่งโครงสร้างเฟสผสมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ แยกอิเล็กตรอนและโฮลให้เสถียรบนพื้นผิวและลดการกลับมารวมตัวกันระหว่างอิเล็กตรอนและโฮล อีกทั้งพบว่าการเพิ่มสัดส่วนของ SiO₂ ปรากฏเฟสโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสเพิ่มขึ้นและการเติม SiO₂ ช่วยลดขนาดผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO₂/SiO₂ หากพิจารณาที่พื้นที่ผิวจำเพาะพบ แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณของสัดส่วน SiO₂ คุณสมบัตินี้เป็นผลสอดคล้องกับรูพรุนที่ปรากฏบน พื้นผิวของ SiO₂ นอกจากนั้นการเติม SiO₂ ช่วยปรับปรุงในส่วนของแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่ง ปฏิกิริยา พบแถบช่องว่างพลังงานอยู่ในช่วง 3.000-3.082 eV ซึ่งเป็นช่วงแถบช่องว่างของโครงสร้าง เฟสแบบรูไทล์ เป็นหลัก การเติม SiO₂ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีความเป็น กรดและหมู่ไฮดรอกซิลเพิ่มขึ้น ซึ่งหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยดักจับโฮลบนพื้นผิวและโมเลกุลของน้ำให้ เกิดการออกซิไดซ์บนพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเติม SiO₂ ที่สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นพบผลกระทบ ต่อการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาบนวัสดุรองรับเกี่ยวกับปัญหาการยึดเกาะที่ไม่ดี ส่วนกลไกทางด้าน ปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสถูกกำหนดด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ เป็นหลัก

5.1.4 สรุปผลการกระจายตัวของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ในห้องจำลองและการ ทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอาหาร

การสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะ ตะไลซิสจากสภาวะการทำงานที่ดีที่สุดดังได้กล่าวในหัวข้อ 5.1.2 ในส่วนนี้ได้ทำการปรับปรุงเครื่อง ปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสโดยการต่ออนุกรมแบบ 3 หน่วยการเกิดปฏิกิริยาร่วมกับการติดตั้งชุดกรอง อากาศ พบว่าสามารถเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้จาก 1.82 ppmv เพิ่มขึ้นเป็น สองเท่าของค่าความเข้มข้นของก๊าซ H₂O₂ หลังจากนั้นทำการยืนยันการมีอยู่ของก๊าซ H₂O₂ ในห้อง ทดสอบการฆ่าเชื้อ พบการเปลี่ยนสีของแผ่นวัดก๊าซ H₂O₂ จากการทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* พบว่ามี แนวโน้มที่จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้ ในงานวิจัยนี้ยังสามารถวัดค่าความขุ่นของ อาหารเลี้ยงเชื้อว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเวลา อาจเนื่องจากก๊าซ H₂O₂ ที่สังเคราะห์ได้ไม่สามารถซึม เข้าไปในอาหารเลี้ยงเชื้อในบริเวณด้านล่างของจานอาหารเลี้ยงเชื้อได้ (ของเหลว) หากปราศจากแรง ขับเคลื่อนจึงทำให้เชื้อ *E. coli* ที่อยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อยังคงเจริญเติบโตต่อไป ในส่วนของการฆ่าเชื้อ บนพื้นผิวของอากาศพบประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวขนมปัง และแอปเปิ้ล จากผลการ ทดสอบพบว่าอาหารแต่ละชนิดมีระยะเวลาในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแตกต่างกัน เนื่องจากบนพื้นผิวของ อาหารแต่ละชนิดมีเชื้อที่แตกต่างชนิดกัน

5.1.5 สรุปผลการวิเ<mark>คราะ</mark>ห์ควา<mark>มเป็นไปได้ทางธุร</mark>กิจของเทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂

จากการทดสอบการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วย กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสพบว่าสามารถสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ ได้จริงและมีแนวโน้มว่าจะสามารถ ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแห้งได้ดี หากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาต่ออย่างเหมาะสมคาดว่าจะกลายเป็นเทคโนโลยี ก๊าซ H₂O₂ ที่ถูกใช้ประโยชน์ในวงกว้าง การประเมินแผนธุรกิจพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ เทคโนโลยีก๊าซ H₂O₂ และพร้อมที่จะเปลี่ยนจากการใช้ผลิตภัณฑ์เดิมมาใช้เทคโนโลยีในโครงการวิจัย โดยให้ความสนใจไปที่ประเด็นการใช้งานได้ไม่จำกัดครั้งและฆ่าเชื้อได้ทุกส่วนบนร่างกายเป็นหลัก

5.2 ข้อเสนอแนะ ¹⁰ายาลัยเทคโนโลยีส์รี

- การสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส ในระบบก๊าซ เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบที่ เกี่ยวข้องหลากหลายตัวแปร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาให้ครอบบคลุมผลกระทบทั้งหมด เพื่อจะได้ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ก๊าซ H₂O₂ เพิ่มมากขึ้น
- การเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂/SiO₂ ลงบนแผ่นตะแกรงสแตนเลสเกิดการยึดเกาะได้ไม่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสต่ำไปด้วย เนื่องจากเป็นการยึดเกาะ กันระหว่างพื้นผิวของแข็งและอนุภาคของแข็งโดยปราศจากตัวเชื่อม ในการศึกษาในลำดับ ถัดไปควรเลือกพิจารณาวัสดุรองรับชนิดอื่นเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องในส่วนนี้ หรือแม้แต่ใช้ สารอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อเพื่อยึดติดพื้นผิวทั้งสองเข้าด้วยกัน

- การซึมผ่านของก๊าซ H₂O₂ เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากหากทำการทดสอบการฆ่าเชื้อในรูปแบบ ของเหลว หากต้องการทดสอบการฆ่าเชื้อในรูปของเหลว จำเป็นต้องอัดก๊าซ H₂O₂ ลงไปใน สารละลายเพื่อทำการฆ่าเชื้อ
- การออกแบบวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับระบบก๊าซ ตัวเร่งปฏิกิริยาควรถูกเคลือบให้ เป็นฟิล์มบางหรืออาจจะต้องปรับปรุงจากวิธีการจุ่มเคลือบเป็นวิธีการเคลือบฟิล์มบางด้วย กระบวนการสปัตเตอริง



รายการอ้างอิง

- ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย (2554). กระบวนการดูดซับ. **โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000.
- ชุติมา สุขอนันต์และคณะ (2554). การกำจัดสปอร์ของ *Bacillus subtilis* ในน้ำด้วยวิธีโฟโตคะตะไล ซิสโดยใช้ตัวกลางและความเร็วในกา<mark>รกว</mark>นต่างกัน. KKU Research Journal. 16(2).
- รชานนท์ กลอนดอน (2556). การกำจัดมลพิษทางอากาศด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดย เคลือบสารผสมไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์บนผิวเครื่องปั้นดินเผาด่าน เกวียน. **คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTIR)**. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา <mark>300</mark>00.
- สุเมธ ภูมิอภิรดี (2550). ไทเทเนียมได<mark>้อ</mark>อกไซด์ (TiO₂) โฟโตแคตาลิสต์ที่เคลือบด้วยอะพาไทต์ (apatite). สถาบันวิจัยวิ<mark>ทยา</mark>ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. **วารสารวิทยาศาสตร์** และเทคโนโลยี. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนา<mark>คม.</mark>
- Akira, F., Tata, N.R. and Donald, A.T. (2000). Titanium dioxide photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. 1(1): 1-21.
- Albers, C.E., Hofstetter, W., Siebenrock, K.A., Landmann, R. and Klenke, F.M. (2013). In vitro cytotoxicity of silver nanoparticles on osteoblasts and osteoclasts at antibacterial concentrations. **Nanotoxicology.** 7: 30-36.
- Andreozzi, R., Caprio, V., Insola, A., and Marotta, R. (1999). Advanced oxidation process (AOP) for water purication and recovery. **Chemical Engineering Journal**. 117: 1098-1107.
- Bahadur, J., Sen, D., Mazumder, S., Sastry, P. U., Paul, B., Bhatt, H., et al. (2012). Onestep fabrication of thermally stable TiO₂/SiO₂ nanocomposite microspheres by evaporation induced self-assembly. Langmuir. 28(31): 11343-11353.
- Bai, J., Rodrigues, A.M., Melendez, J.A. and Cederbaum, A.I. (1999). Overexpression of catalase in cytosolic or mitochondrial compartment protects HepG2 cells against oxidative injury. Journal of Biological Chemistry. 274: 26217-26224.

- Balachandran, K., Venckatesh, R., Sivaraj, R., and Rajiv, P. (2014). TiO₂ nanoparticles versus TiO₂-SiO₂ nanocomposites: a comparative study of photocatalysis on acid red 8.8. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectro-scopy. 128: 468–474.
- Bellardita, M., Addamo, M., Paola, A.D., Marci, G., Palmisano, L., Cassar, L. and Borsa, M. (2010). Photocatalytic activity of TiO₂/SiO₂ systems. Journal of Hazardous Materials. 174: 707-713.
- Cannalire, R., Pelliccia, S., Sancineto, L., Novellino, E., Tron, G.C. and Giustiniano, M. (2021). Visible light photocatalysis in the late-stage functionalization of pharmaceutically relevant compounds. **Chemical Society Reviews.** 50: 766-897.
- Chance, B., Sies, H. and Boveris, A. (1979). Hydroperoxide metabolism in mammalian orans. Physiological Reviews. 59: 527-605.
- Collin, G.J., Yun, H.T-Y, Musta, B., Sarjadi, M.S. and Elilarasi, L. (2021). Application of plasmonic metal nanoparticles in TiO₂-SiO₂ composite as an efficient solaractivated photocatalyst: A review paper. **Frontiers in Chemistry.** 8: 568063.
- Deanna, C.H., Alexander, G.A. and Kimberly, A.G. (2003). Explaining the enhanced photocatalytic Activity of degussa P25 mixed-phase TiO₂ using EPR. **The Journal** of Physical Chemistry B. 107: 4545-4549.
- Enzo, G.P., Stefano, L., Sara, M., Valeria, P. Mario, C. and Elio, G. (2016). Role of surface water molecules in stabilizing trapped hole centres in titanium dioxide (anatase) as monitored by electron paramagnetic resonance. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 322-323: 27-34.
- Fateh, R., Dillert, R., and Bahnemann, D. (2013). Preparation and characterization of transparent hydrophilic photocatalytic TiO₂/SiO₂ thin films on polycarbonate. Langmuir. 29(11): 3730-3739.
- Fatimah, I., Said, A., and Hasanah, U. A. (2015). Preparation of TiO₂-SiO₂ using rice husk ash as silica source and the kinetics study as photocatalyst in methyl violet decolorization. **Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis.** 10(1): 43-49.
- Fernandez, P.M., Vinarta, S.C., Bernal, A.R., Cruz, E.L. and Figueroa, L.I.C. (2018). Bioremediation strategies for chromium removal: Current research, scale-up approach and future perspectives. **Chemosphere.** 208: 139-148.

- Finnegan, M., Linley, E., Denyer, S.P., McDonnell, G., Simons, C. and Maillard, J-Y. (2010). Mode of action of hydrogen peroxide and other oxidizing agents: differences between liquid and gas form. Antimicrob Chemother. 65: 2108-2115.
- Frei, B., Yamamoto, Y., Niclas, D. and Ames, B.N. (1988). Evaluation of an isoluminol chemiluminescence assay for the detection of hydroperoxides in human blood plasma. **Analytical Biochemistry.** 175: 120-130.
- Fujishima, A., Zhang, X. and Tryk, D.A. (2008). TiO₂ photocatalysis and related surface phenomena. **Surface Science Reports.** 63: 515-582.
- Fujita, Y., Wakabayashi, K., Nagao, M. and Sugimura, T. (1985). Implication of hydrogen peroxide in the mutagenicity of coffee. Mutation Research Letters. 144: 227-230.
- Halliwell, B., Clement, M.V., and Long, L.H. (2000). Hydrogen peroxide in the human body. FEBS Letters. 486(1): 10-13.
- Halliwell, B. and Gutteridge, J.M.C (1999). Free radicals in biology and medicine, 3rd edn., Clarendon Press. Oxford.
- Haodong, J., Penghui, D., Dongye, Z., Si, L. Fengbin, S., Evert, C.D. and Wen, L. (2020).
 2D/1D graphitic carbon nitride/titanate nanotubes heterostructure for efficient photocatalysis of sulfamethazine under solar light: Catalytic "hot spots" at the rutile–anatase–titanate interfaces. Applied Catalysis B: Environmental. 263: 118357.
- Haodong, J., Wen, L., Fengbin, S., Taobo, H., Long, C., Yue, L., Juanjuan, Q., Chenghan, X. and Dongye, Z. (2021). Experimental evidences and theoretical calculations on phenanthrene degradation in a solar-light-driven photocatalysis system using silica aerogel supported TiO₂ nanoparticles: Insights into reactive sites and energy evolution. **Chemical Engineering Journal.** 419: 129605.
- Hiramoto, K., Li, X., Makimoto, M., Kato, T. and Kikugawa, K. (1998). Identification of hydroxyhydroquinone in coffee as a generator of reactive oxygen species that break DNA single strands. **Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis.** 419: 43-51.
- Hou, H., Zeng, X. and Zhang, X. (2020). Production of hydrogen peroxide by photocatalytic processes. Angewandte Chemie International Edition. 59: 17356-17376.

- James, D. L. and Douglas, J.B. (2019). Purified hydrogen peroxide gas generation method and devices. **U.S. Pat. 10,232,076.**
- Jenny, S., Masaya, M., Masato, T., Jinlong, Z., Yu, H., Masakazu, A. and Detlef, W.B. (2014). Understanding TiO₂ Photocatalysis: Mechanisms and Materials. **Chemical Reviews.** 114(19): 9919-9986.
- Jerneja, S.O., Elizabeta, T.P., Lev, M. and Peter, B. (2012). Antibacterial and photodegradative properties of Metal Doped TiO2 thin Films Under Visible Light. Acta Chimica Slovenica. 59: 264-272.
- Jeon, H., Lee, C. S., Patel, R., and Kim, J. H. (2015). Well-organized mesomacroporous TiO₂/SiO₂ film derived from amphiphilic rubbery comb copolymer. **ACS Applied Materials & Interfaces.** 7(14): 7767-7775.
- Junjian, Z., Jingwen, X., Xiaoxia, J., Jing, X., Zhida, Gao. And Yan-Yan, S. (2020). NIR lightdriven photocatalysis on amphiphilic TiO₂ nanotubes for controllable drug release. **ACS Applied Materials & Interfaces.** 12(20): 23606-23616.
- Kanai, N., Nuida, T., Ueta, K., Hashimoto, K., Watanabe, T. and Ohsaki, H. (2004). Photocatalytic efficiency of TiO₂/SnO₂ thin film stacks prepared by DC magnetron sputtering. **Vacuum.** 74: 723-727.
- Kibombo, H.S., Peng, R., Rasalingam, S., and Koodali, R. T. (2012). Versatility of heterogeneous photocatalysis: synthetic methodologies epitomizing the role of silica support in TiO₂ based mixed oxides. Catalysis Science & Technology. 2(9): 1737–1766.
- Kim, K.D. and Kim, H.T. (2005). Comparison of growth mechanism of TiO₂-coated SiO₂ particles prepared by sol-gel process and water-in-oil type microemulsion method. Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects. 255: 131-137.
- Kiyoshi, O., Nobuo, Y., Yoshikazu, K. and Atsuo, Y. (2001). Effect of silica additive on the anatase-to-rutile phase transition. Journal of the American Ceramic Society. 84(7): 1591-96.
- Kshirsagar, A.S. and Khanna, P.K. (2018) Titanium dioxide (TiO₂)-decorated silver indium diselenide (AgInSe₂): Novel nano-photocatalyst for oxidative dye degradation. Inorganic Chemistry Frontiers. 5: 2242-2256.

- Lai, S.Y., Ng, K.H., Cheng, C.K., Nur, H., Nurhadi, M. and Arumugam, M. (2021). Photocatalytic remediation of organic waste over Keggin-based polyoxometalate materials: A review. **Chemosphere.** 263: 128244.
- Li, T., Li, H., and Li, C. (2020). A review and perspective of recent research in biological treatment applied in removal of chlorinated volatile organic compounds from waste air. **Chemosphere.** 250: 126338.
- Liga, M. V., Maguire-Boyle, S. J., Jafry, H. R., Barron, A. R., and Li, Q. (2013). Silica decorated TiO₂ for virus inactivation in drinking water–simple synthesis method and mechanisms of enhanced inactivation kinetics. **Environmental Science & Technology.** 47(12): 6463-6470.
- Long, L.H., Lan, A.N.B., Hsuan, F.T.Y. and Halliwell, B. (1999). Generation of hydrogen peroxide by "Antioxidant" beverages and the effect of milk addition. Is cocoa the best beverage?. **Free Radical Research.** 31: 67-71.
- Mamaghani, A.H., Haghighat, F. and Lee, C-S. (2020). Hydrothermal/solvothermal synthesis and treatment of TiO₂ for photocatalytic degradation of air pollutants: Preparation, characterization, properties, and performance. **Chemosphere.** 219: 804-825.
- Matsumoto, A., Okado, A., Fujii, T., Fujii, J., Egashira, M., Niikawa, N. and Taniguchi, N. (1999). Cloning of the peroxiredoxin gene family in rats and characterization of the fourth member. **FEBS Letters.** 443: 246-250.
- McKeen, L. (2012). The effect of sterilization on plastics and elastomers: Introduction to food irradiation and medical sterilization. Fourth Edition: Matthew Deans Publishers.
- Panayotov, D., and Yates, J. T. (2003). Bifunctional hydrogen bonding of 2-chloroethyl ethyl sulfide on TiO₂–SiO₂ powders. The Journal of Physical Chemistry B. 107(38): 10560-10564.
- Price, D., Worsfold, P.J., Mantoura, R. and Fauzi, C. (1992). Hydrogen peroxide in the marine environment: cycling and methods of analysis. **Trends in Analytical Chemistry.** 11(10): 379-384.
- Raghunath, A. and Perumal, E. (2017). Metal oxide nanoparticles as antimicrobial agents: A promise for the future. International Journal of Antimicrobial Agents. 49: 137-152.

- Ramamoorthy, V., Kannan, K., Joseph, J., Infant, A., Kanagaraj, T., Thiripuranthagan, S. (2016). Photocatalytic degradation of acid orange dye using silver impregnated TiO₂/SiO₂ composite catalysts. **Journal of Nanoscience and Nanotechnology.** 16(9): 9980-9986.
- Ren, Y., Chen, M., Zhang, Y., and Wu, L. (2010). Fabrication of rattle-type TiO₂/SiO₂ core/shell particles with both high photoactivity and UV-shielding property. Langmuir. 26(13).
- Shirzadi-Ahodashti, M., Ebrahimzadeh, M.A., Ghoreishi, S.M., Naghizadeh, A. and Mortazavi-Derazkola, S. (2020). Facile and eco-benign synthesis of a novel MnFe₂O₄@SiO₂@Au magnetic nanocomposite with antibacterial properties and enhanced photocatalytic activity under UV and visible-light irradiations. **Applied Organometallic Chemistry.** 34: e5614.
- Sreeja, S. and Vidya, S. (2017). Photocatalytic water disinfection under solar irradiation by Ag@TiO₂ core-shell structured nanoparticles. **Solar Energy.** 157: 236-243.
- Smith, H. (1977). Microbial surfaces in relation to pathogenicity. In **Bacteriological Reviews** (Vol. 41, pp. 475-500). U.S.A.: American Society for Microbiology.
- Szymczak, R. and Waite, T.D., (1991). Photochemical activity in waters of the Great Barrier Reef. Estuarine Coastal and Shelf Science. 33(6): 605-622.
- Tang, M.M. and Bacon, R. (1964). Carbonization of cellulose fibers. Part I: Low temperature pyrolysis. Carbon. 2(3): 211-220.
- Tanongsak, S., Aroonsri, N., Pattanapong, J. and Supunnee, J. (2022). TiO₂/SiO₂ coated 310S stainless steel for hydrogen peroxide generation via photocatalytic reaction. **Current Applied Science and Technology.** 22(3).
- Takagi, Y., Mitsui, A., Nishiyama, A., Nozaki, K., Sono, H., Gon, Y., Hashimoto, N. and Yodoi, J. (1999). Overexpression of thioredoxin in transgenic mice attenuates focal ischemic brain damage. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 96: 4131-4136.
- Ueda, J., Saito, N., Shimazu, Y. and Ozawa, T. (1996). A comparison of scavenging abilities of antioxidants against hydroxyl radicals. Archives of Biochemistry and Biophysics. 333: 377-384.
- Venturini, L. and Bacchi, M. (2009). Research, Design and development of photocatalytic asphalt pavement. **Proceeding on 2nd International Conference Environ-mentally Friendly Roads.** ENVIROAD.

- Wei, Z., Ling, J., Ze-mei, G., Xin, W., Run-tao, L. (2018). A continuous-flow synthesis of primary amides from hydrolysis of nitriles using hydrogen peroxide as oxidant. Tetrahedron. 74: 1527-1532.
- Weller, R., and Schrems, O. (1993). H₂O₂ in the marine troposphere and seawater of the Atlantic Ocean (48°N-63°S). **Geophysical Research Letters.** 20(2): 125-128.
- Willey, J.D., Paerl, H.W., and Go, M. (1999). Impact of rainwater hydrogen peroxide on chlorophyll a content of surface gulf stream seawater off North Carolina, USA. Marine Ecology Progress Series. 178: 145-150.
- Xiaona, L., Haodong, J., Si, L. and Wen, L. (2019). Graphene modified anatase/titanate nanosheets with enhanced photocatalytic activity for efficient degradation of sulfamethazine under simulated solar light. **Chemosphere.** 233: 198-206.
- Yang, H., Zhang, K., Shi, R., Li, X., Dong, X. and Yu, Y. (2006). Sol–gel synthesis of TiO₂ nanoparticles and photocatalytic degradation of methyl orange in aqueous TiO₂ suspensions. Journal of Alloys and Compounds. 413: 302-306.
- Zhang, X., Wang, J., Dong, X-X. and Lv, Y-K. (2020). Functionalized metal-organic frameworks for photocatalytic degradation of organic pollutants in environment. **Chemosphere. 2**42: 125144.
- Zhuqing, Z., Muya, C., Haijia, Z., Qiang, M., Hongwei, X., Pengfei, X. and Yin, Z.Z. (2022). Zincothermic-reduction-enabled harvesting of an Si/C composite from rice husks for a Li-ion battery anode. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 10: 5035-5042.

รัฐว_ักยาลัยเทคโนโลยีสุรุบโ

ภาคผน<mark>วก</mark> ก.

ับทความวิชาการ<mark>ที่ได้</mark>รับการตีพิมพ์เผ<mark>ยแ</mark>พร่ในระหว่างการศึกษา



รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างการศึกษา

- Sukkasem, T., Nuchitprasittichai, A., Janphuang, P., and Junpirom, S. (2022). TiO₂/SiO₂ coated 310S stainless steel for hydrogen peroxide generation via photocatalytic reaction. **Current Applied Science and Technology.** 22(3).
- Sukkasem, T., Nuchitprasittichai, A., Janphuang, P., and Junpirom, S. "TiO₂/SiO₂ coated 310S stainless steel for hydrogen peroxide generation via photocatalytic reaction" The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology, 1st-4th December 2020, Pattaya, Thailand.



Current Applied Science and Technology Vol. 22 No. 3 (May-June 2022)

Research article

TiO₂/SiO₂ Coated 310S Stainless Steel for Hydrogen Peroxide Generation via Photocatalytic Reaction

Tanongsak Sukkasem¹, Aroonsri Nuchitprasittichai¹, Pattanapong Janphuang² and Supunnee Junpirom^{1*}

¹School of Chemical Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand ²Synchrotron Light Research Institute, Nakhon Ratchasima, Thailand

Received: 2 February 2021, Revised: 18 June 2021, Accepted: 11 August 2021

DOI: 10.55003/cast.2022.03.22.001

Abstract

Keywords

TiO₂/SiO₂; photocatalysis; hydrogen peroxide

The photocatalytic reactor was designed by assembling the parts of a photocatalyst, an ultraviolet light source and an air distribution. This prototype reactor was used to generate H₂O₂ via photocatalytic reaction. TiO₂ and TiO₂/SiO₂ prepared from sol-gel method were coated on 310S stainless steel substrate using dip-coating technique. Rice husk ash was used as the source of SiO₂. The major phase of all the pure TiO₂ and SiO₂ particles was anatase and amorphous, respectively. The surface analysis showed the coated TiO₂ and TiO₂/SiO₂ with an average roughness of 365.391 and 1322.001 nm, respectively, compared with the average thickness of coated TiO₂ which was measured to be 2.7325 µm and for TiO₂/SiO₂, which was 4.7856 µm. The results also showed the coating of TiO₂/SiO₂ was highly porous at the surface compared with pure TiO₂. The TiO₂/SiO₂ show good photocatalytic reaction activity because SiO₂ doping on TiO₂ increased the adsorption of O₂ and H₂O molecules towards the photoactive center of TiO₂. Thus, the incorporation of SiO₂ onto the photocatalyst helped to increase photocatalytic activity. The generation of H₂O₂ increased with increasing ambient humidity up to 60% RH, but then decreased. This behavior was explained by the effect of water vapor adsorption on the SiO₂ surface. The air flowrate enhanced the generation of H₂O₂, higher air flow rate produced a higher amount of H2O2. H2O2 was generated at the highest concentration of 64 ppmv from the TiO2/SiO2 photocatalyst at ambient humidity of 60% RH and air flowrate 8.20 m/s.

*Corresponding author: Tel.: 0 4422 4245 Fax: 0 4422 4220 E-mail: supunnee@sut.ac.th 1

ประวัติผู้เขียน

นายทนงศักดิ์ สุขเกษม เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด อุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2563 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ้วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ้สุรนารี สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2565 โดยใ<mark>นข</mark>ณะกำลังศึกษาระดับปริญญาโทได้รับทุนงานวิจัยและ เป็นผู้ช่วยวิจัยหลากหลายโครงการ อาทิเช่น <mark>โค</mark>รงการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ เรื่อง เครื่องฟอกอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอ<mark>ร์ออกไ</mark>ซด์จากปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส ทุนงบประมาณ 400,000 บาท แหล่งทุนวิจัยเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการส่งเสริมการนำ ้นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒ<mark>น</mark>าสังคมแ<mark>ล</mark>ะชุมชน หัวข้อเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิต ้น้ำส้มควันไม้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีอิน<mark>ทรี</mark>ย์ตะคุสำห<mark>รับใ</mark>ช้งานด้านการเกษตรอินทรีย์ ทุนงบประมาณ 100,000 บาท แหล่งทุนวิจัยเทคโ<mark>นธานี้ ม</mark>หาวิทยาลัยเท<mark>คโน</mark>โลยีสุรนารี ปังบประมาณ 2565 โครงการ การพัฒนาการผลิตพลังงานชีวภา<mark>พ ส</mark>ารเคมีชีวภาพและวั<mark>สดุท</mark>ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง การ พัฒนาการผลิตไบโอเอทิลีนจา<mark>กไ</mark>บโอเอทานอล ทุนงบประมาณ 400,000 บาท แหล่งทุนวิจัยด้านวิจัย และนวัตกรรม ประเภท Fundamental fund ปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยในการดูแล ึกลุ่มโครงงานห้องเรียน<mark>วิทย</mark>าศ<mark>าสตร์ (SCIUS projects) แ</mark>ละโ<mark>คร</mark>งงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Senior project) ภายใ<mark>ต้องค์ความรู้ในเรื่อง กระบวนกา</mark>รโฟโ<mark>ตคะต</mark>ะไลซิส กระบวนการดีไฮเดรชัน แบบใช้ตัวเร่งของเอทาน<mark>อล การสังเคราะห์ซีโอไลต์ กระบวนกา</mark>รไพโรไลซิส การสังเคราะห์นาโน เซลลูโลสจากกัญชง การเคลือบโ<mark>พลีแลกติกบนยา และการ</mark>สลายก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น

⁷วักยาลัยเทคโนโลยีสุรุ^ง